

Menschen mit Visionen



Geschäftsbericht 2016

Kennzahlen

| <i>in Mio. €</i> | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Veränderung 2016/2015 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Geschäftsentwicklung | | | |
| Auftragseingang | 161,1 | 188,6 | - 14,6 % |
| Auftragsbestand zum 31.12. | 101,5 | 117,6 | - 13,7 % |
| Umsatz gesamt | 177,6 | 148,5 | 19,6 % |
| Umsatzrendite | 2,8 % | 0,1 % | 2,7 %-Punkte |
| Rohertrag | 58,6 | 49,4 | 18,6 % |
| Rohertragsmarge | 33,0 % | 33,3 % | - 0,3 %-Punkte |
| Herstellungskosten | 119,0 | 99,2 | 20,0 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,1 | 12,8 | 10,2 % |
| EBITDA | 15,3 | 9,2 | 66,3 % |
| EBITDA-Marge | 8,6 % | 6,2 % | 2,4 %-Punkte |
| EBIT | 11,1 | 5,0 | > 100,0 % |
| EBIT-Marge | 6,3 % | 3,4 % | 2,9 %-Punkte |
| Ergebnis nach Steuern | 5,0 | 0,2 | > 100,0 % |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in EUR) | 0,26 | 0,01 | > 100,0 % |
| Bilanz und Cashflow | | | |
| Eigenkapital | 124,4 | 118,7 | 4,8 % |
| Eigenkapitalquote | 69,2 % | 67,0 % | 2,3 %-Punkte |
| Eigenkapitalrentabilität | 4,0 % | 0,2 % | 3,9 %-Punkte |
| Bilanzsumme | 179,6 | 177,2 | 1,4 % |
| Net Cash | 31,1 | 40,0 | - 22,3 % |
| Free Cashflow ¹ | -9,1 | 1,3 | < - 100,0 % |
| Weitere Kennzahlen | | | |
| Investitionen | 3,6 | 3,4 | 5,9 % |
| Investitionsquote | 2,0 % | 2,3 % | - 0,3 %-Punkte |
| Abschreibungen | 4,2 | 4,2 | 0,0 % |
| Mitarbeiter zum 31.12. | 711 | 698 | 1,9 % |

¹ Vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen.

Weltweit visionär

LITHOGRAFIE

- Mask-Aligner
- UV-Projektionsbelichtungssysteme
- Laser-Prozessierungssysteme
- Belacker/Entwickler

Auftragseingang: **105,0 Mio. €**
Umsatz: **133,8 Mio. €**
EBIT: **13,2 Mio. €**

BONDER

- Bonder

Auftragseingang: **18,6 Mio. €**
Umsatz: **14,0 Mio. €**
EBIT: **-1,7 Mio. €**

FOTOMASKEN-EQUIPMENT

- Fotomasken-Bearbeitungssysteme

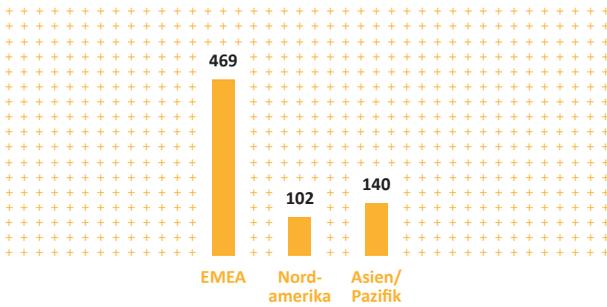
Auftragseingang: **26,3 Mio. €**
Umsatz: **19,7 Mio. €**
EBIT: **1,8 Mio. €**

SONSTIGE

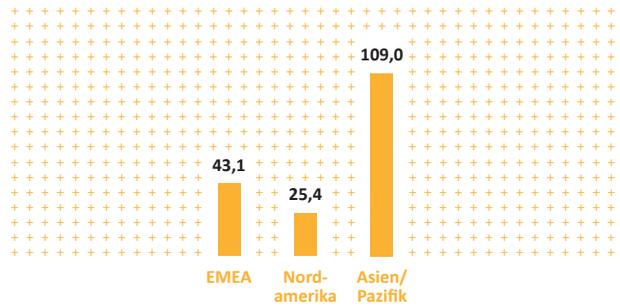
- Mikrooptik und -linsen
- Zentrale Konzernfunktionen

Auftragseingang: **11,2 Mio. €**
Umsatz: **10,1 Mio. €**
EBIT: **-2,1 Mio. €**

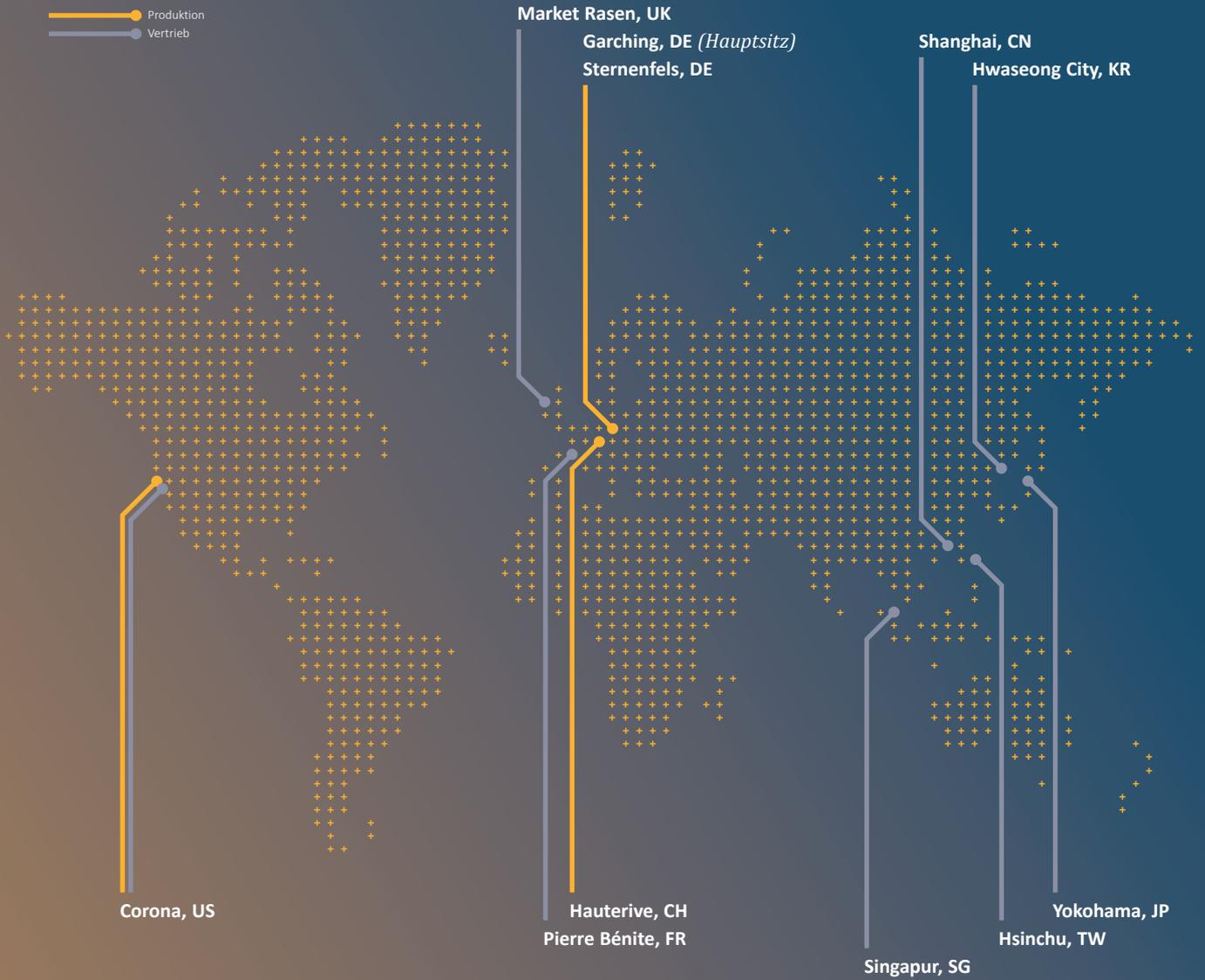
MITARBEITER NACH REGIONEN



UMSATZ NACH REGIONEN in Mio. €



—●— Produktion
—●— Vertrieb



UMSATZ NACH REGIONEN

14,3 %

Nordamerika

24,3 %

EMEA

61,4 %

Asien/Pazifik

Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem Geschäftsfeld sind wir täglich mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontiert, die wir mit Kreativität und Leistungsbereitschaft lösen. Eine wesentliche Voraussetzung, uns weiterhin im Markt erfolgreich zu behaupten. Wir agieren in sich schnell verändernden Märkten mit extrem anspruchsvollen Kunden. Es werden ständig neue Lösungen von uns gefordert, die wir nur mit einer motivierten und leistungsbereiten Mannschaft erbringen können. Dass wir das können, haben wir in unserer langen Unternehmensgeschichte immer wieder bewiesen und beweisen es in vielen Bereichen täglich aufs Neue. Wir setzen auf unsere Mitarbeiter mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und einem sehr guten Marktverständnis. Dieses, gepaart mit unserer Innovationsstärke und einer hohen Kosteneffizienz, ist für uns der Schlüssel zum Erfolg.

IHR SÜSS MICROTEC-VORSTAND

Inhalt

| | |
|---|-----------------------------|
| Vorwort des Vorstands | 4 |
| Bericht des Aufsichtsrats | 6 |
| Menschen mit Visionen | 10 |
| Investor Relations | 42 |
| Corporate Governance | 46 |
| Zusammengefasster Lagebericht | 52 |
| Konzernabschluss nach IFRS | 102 |
| Anhang zum IFRS-Konzernabschluss | 118 |
| Glossar | 150 |
| Finanzkalender 2017 | <i>Umschlagseite hinten</i> |
| Fünfjahresübersicht | <i>Umschlagseite hinten</i> |



Vorwort des Vorstands

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 war geprägt von hohen Umsätzen, wie wir sie zuletzt im Geschäftsjahr 2011 gesehen haben, sowie einer gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserten Profitabilität. Unsere anhaltenden Bemühungen, noch schneller und gezielter auf Marktanforderungen sowie auf Kundenwünsche und -bedürfnisse einzugehen, wurden in den beiden zurückliegenden Geschäftsjahren durch gute Auftragseingänge und Umsätze belohnt. Nach einer Stabilisierung des Umsatzes und des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2015 konnten wir in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld den Umsatz gegenüber Vorjahr um 19,6 Prozent steigern. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) konnte im gleichen Zeitraum sogar mehr als verdoppelt werden.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir uns auf dem Erreichten ausruhen werden. Der Vorstand wird den eingeschlagenen Wachstumspfad konsequent weiterverfolgen und dabei noch mehr Gewicht auf die Verbesserung der Ertragslage legen. Nachhaltiges Wachstum in der Halbleiter-Equipment-Branche bedeutet nicht zwangsläufig, jedes Jahr einen höheren Umsatz auszuweisen. Dies ist bei der Komplexität und Zyklizität der Märkte schwerlich möglich. Wir wollen Ihr Unternehmen jedoch in einem überschaubaren Zeitrahmen auf ein deutlich höheres und nachhaltigeres Umsatz- und Ergebnisniveau heben.

Wir sind in schnelllebigem Märkten mit sehr anspruchsvollen Kunden tätig. Durch Produktlebenszyklen von nur wenigen Jahren, wenn überhaupt, stehen die Kunden vor der Herausforderung, ständig neue Technologien zu erfinden. Wir als Ausrüster müssen diesen Trend unterstützen und modernste Lösungen für unsere Kunden anbieten. Aber wir sind nicht mehr nur ein Maschinenbauer, sondern wir betreiben darüber hinaus eine intensive Prozessentwicklung und -optimierung. Wir benötigen ein umfassendes und tief gehendes Verständnis der Prozesse und Technologien, die derzeit von unseren Kunden in der Produktion verwendet werden. Nur so können wir unsere Maschinen zum besten Nutzen unserer Kunden weiterentwickeln. Wir, als Vorstand Ihres Unternehmens, sind fest davon überzeugt, dass einige unserer Märkte in den kommenden Jahren stark wachsen werden. Wafer-Level-Fan-out, ggf. auch Panel-Level-Fan-out und letztendlich die 3D-Integration mit TSVs werden bei der Chip-Integration zukünftig eine dominierende Rolle spielen.

Wir sehen jedoch nicht nur im Bereich Packaging starke Wachstumschancen. Ein ähnliches Wachstum kann durch neue Entwicklungen wie „Industrie 4.0“ oder das „Internet der Dinge“ (IoT), die zu völlig neuen Möglichkeiten bei Mobilität, Konnektivität und Cloud-Computing führen, generiert werden. Auf der Ebene der Endgeräte gibt es einen starken Bedarf für mehr MEMS

(mikro-elektromechanische Systeme) und optische Systeme, um eine noch schnellere Kommunikation und bessere Konnektivität zu unterstützen. Spannende und anspruchsvolle Herausforderungen liegen vor unseren Kunden und unserem Unternehmen. In vielen Fällen können herausragende Lösungen und Ergebnisse nur erreicht werden, wenn Anwender und Entwickler von Produktionsanlagen eng kooperieren, um den gesamten Produktionsprozess für höchste Qualität und Produktivität zu optimieren. Als Equipment-Anbieter arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und erstklassige Lösungen für ihre Anforderungen zu bieten. In diesen bewegten Zeiten ist es nach wie vor unser Ziel, der anerkannte Ansprechpartner, insbesondere für Lithografielösungen, im Halbleiter-Mid- und -Backend zu sein.

Produktseitig konnten wir dem Markt im zurückliegenden Geschäftsjahr verschiedene Neuerungen präsentieren. Wir haben beispielsweise im April 2016 eine umweltfreundliche Innovation in der Produktlinie Mask-Aligner eingeführt. Mit der Entwicklung und Umsetzung des umweltfreundlichen UV-LED-Lampenhauskonzepts für Mask-Aligner ist uns ein weiterer wichtiger Schritt im Hinblick auf Ressourcenschonung und Umweltschutz gelungen. Die Lebensdauer der innovativen UV-LED-Lichtquelle ist um ein Vielfaches höher als bei der bisher verwendeten Quecksilberdampfampe. Zusätzlich entfallen im Produktionsprozess die zeit- und energieintensiven Aufwärm- und Abkühlphasen. Die LED-Lichtquelle muss nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Belichtung tatsächlich durchgeführt wird. Diese Eigenschaften führen bei unseren Kunden zu erheblichen Kosten- und Zeiteinsparungen. Im Sommer 2016 haben wir eine neue Generation unseres halbautomatischen Mask- und Bond-Aligners MA/BA-Gen4 in den Markt eingeführt. Dieser zeichnet sich durch verbesserte Fähigkeiten im Hinblick auf Justiergenauigkeit, Ergonomie sowie geringere Betriebskosten aus. Mit der Einführung dieses Systems haben wir unser Produktportfolio der Mask-Aligner optimiert, um den Kundenansprüchen zukünftig noch besser entsprechen zu können. Als drittes Beispiel sei hier noch die Markteinführung der ACS300 Gen3 genannt. Hierbei handelt es sich um eine Belacker- und Entwicklerplattform, welche speziell für die Massenfertigung im Bereich Advanced Packaging konzipiert ist.

Trotz der guten Geschäftsentwicklung und der vielversprechenden Produktneuerungen sind wir mit der Aktienkursentwicklung im Geschäftsjahr 2016 nicht zufrieden. Die Aktie entwickelte sich zu Jahresbeginn 2016 zunächst gut. Die deutlichen Kursgewinne waren höchstwahrscheinlich dem Rekordauftragseingang im vierten Quartal 2015 sowie dem Wiederaufstieg in den TecDAX im März 2016 geschuldet. Diese positive Kursentwicklung setzte sich leider im Jahresverlauf nicht fort. Seit Anfang Mai 2016 befand sich die Aktie in einem Abwärtstrend, der am 16. November



Von links nach rechts:
 Michael Knopp, Finanzvorstand
 Dr. Franz Richter, Vorstandsvorsitzender
 (seit September 2016)
 Walter Braun, Produktionsvorstand

2016 mit einem Jahrestiefstkurs von 5,47 Euro seinen Tiefpunkt fand. Bis zum Jahresende bewegte sich die Aktie in einem Korridor von rund 6,00 Euro bis 6,50 Euro.

VORSTANDSWECHSEL

Meine Damen und Herren, im Geschäftsjahr 2016 gab es erneut einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Der damalige Vorstandsvorsitzende Dr. Per-Ove Hansson legte sein Amt am 16. August 2016 nieder. Bereits am 30. August 2016 konnte der Aufsichtsrat mit Dr. Franz Richter einen Nachfolger für die Position des Vorstandsvorsitzenden gewinnen, welcher die Halbleiterbranche und darüber hinaus das Unternehmen sehr gut kennt. Er war in der Vergangenheit bereits als Vorstandsvorsitzender und später als Aufsichtsrat für SÜSS MicroTec tätig. Wie eingangs bereits erläutert, wird der Vorstand den Fokus jetzt noch stärker auf profitables und nachhaltiges Wachstum richten.

AUSBLICK

Das Geschäftsjahr 2016 war von politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen geprägt, welche sich unter anderem um das verlangsamte Wirtschaftswachstum in China, den Brexit und seine möglichen Folgen, Terroranschläge in Europa und kriegerische Konflikte im Nahen Osten sowie die Flüchtlingssituation und nicht zuletzt um den Wahlausgang in der US-Präsidentenwahl drehten. In dieser turbulenten Zeit betrug das Weltwirtschaftswachstum gemäß den Schätzungen des ifo Instituts rund 2,4

Prozent. Die Wirtschaft im Euroraum konnte um 1,6 Prozent zulegen. Für das laufende Geschäftsjahr gehen führende Wirtschaftsforschungsinstitute von einem globalen Wachstum um 2,9 Prozent sowie im Euroraum von einem Wachstum um 1,5 Prozent aus. Für die Halbleiterbranche registrierten Experten wie Gartner oder die Semiconductor Industry Association einen Umsatzanstieg um 1,5 Prozent im zurückliegenden Geschäftsjahr. Für 2017 erwarten beide einen deutlichen Zuwachs um rund 7,2 Prozent gegenüber 2016.

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2016 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2017 prognostiziert das Unternehmen nun einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 160 und 170 Mio. Euro. Dies ist eine leichte Erhöhung der Umsatzerwartung vom Juli 2016, die sich auf rund 160 Mio. Euro belief. Das EBIT für 2017 wird trotz des geringeren Umsatzes voraussichtlich erneut in einer Bandbreite von 9 bis 13 Mio. Euro liegen. Der Hauptgrund hierfür ist die Erwartung einer gegenüber Vorjahr verbesserten Rohertragsmarge.

Garching, im März 2017

Dr. Franz Richter
 Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp
 Finanzvorstand

Walter Braun
 Produktionsvorstand

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, mit nachfolgendem Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 informieren.



Dr. Stefan Reineck, *Aufsichtsratsvorsitzender*

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben im Jahr 2016 nachgekommen und hat den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und unterrichtete ihn regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden im Einzelnen erläutert und vom Aufsichtsrat anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand ausführlich erörtert, zu zustimmungspflichtigen Geschäften hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2016 fanden insgesamt sieben ordentliche und eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats statt.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und informierte sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle. Im ganz besonderen Fokus der Kommunikation stand dabei die Entwicklung der bei der SUSS MicroTec Photonic Systems angesiedelten Produktlinien UV-Scanner und Laser-Stepper. Darüber hinaus stand der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand und den Jahresabschlussprüfern, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zu Themen der Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung.

SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die strategische Ausrichtung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. Der Aufsichtsrat befasste sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen eingegangen.

Die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres 2016 fand am 10. Februar 2016 statt. Hierbei befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2015 und den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2015. Der Aufsichtsrat erörterte die Planung für das Geschäftsjahr 2016 sowie die Mehrjahresplanung 2016–2018 und stimmte der Planung für das Geschäftsjahr 2016 zu. Darüber hinaus erörterte er die Ziele und den Bonusplan für den Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 sowie die langfristigen Ziele. In dieser Sitzung diskutierte der Aufsichtsrat außerdem die Ziele und die Kriterien zur Besetzung des Aufsichtsrats. Daneben führte der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese. Schließlich beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit den strategischen Optionen des Unternehmens angesichts der sich verstärkenden M&A-Aktivitäten anderer Unternehmen aus der Branche.

An der zweiten Sitzung am 29. März 2016 nahmen Vertreter des Abschlussprüfers, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teil. Diese berichteten dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015. Der Abschlussprüfer erläuterte dem Aufsichtsrat die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2015 und zur aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2016 nahm der Aufsichtsrat zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2015. Außerdem beschloss der Aufsichtsrat seinen Bericht an die Hauptversammlung im Hinblick auf seine Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015. Darüber hinaus genehmigte der Aufsichtsrat die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen für die Hauptversammlung am 15. Juni 2016. Schließlich befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Vorstandsbonus 2015 und erörterte die Ziele des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 sowie die lang-

fristigen Dreijahresziele. Im Anschluss fasste er Beschluss über den Bonusplan des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 sowie die langfristigen Dreijahresziele. Weiterer Schwerpunkt der Aufsichtsratssitzung waren erneut die strategischen Optionen des Unternehmens vor dem Hintergrund der sich verstärkenden M&A-Aktivitäten anderer Unternehmen aus der Branche.

Die dritte ordentliche Aufsichtsratssitzung fand am 3. Mai 2016 statt. Der Aufsichtsrat befasste sich mit der aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2016 sowie dem Ausblick auf das Gesamtjahr 2016. Zudem diskutierte er eingehend über die an die SÜSS MicroTec Photonic Systems ausgereichten Intercompany-Darlehen und die damit verbundenen Risiken. Im Anschluss stimmte der Aufsichtsrat einem unwiderruflichen Darlehensverzicht der SÜSS MicroTec AG gegenüber der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. zu. Weitere Themen der Sitzung waren der Zugang zu angrenzenden Märkten und der Status der Produktlinie Laser-Imaging. Schließlich erörterte der Aufsichtsrat mit dem Vorstand einzelne, bedeutende Kundenprojekte.

In der Sitzung am 15. Juni 2016, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, informierte der Vorstand den Aufsichtsrat über die aktuelle Geschäftslage. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde die Sitzung des Aufsichtsrats fortgesetzt. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat über aktuelle Entwicklungen zu verschiedenen Kunden- und Entwicklungsprojekten. Zudem erörterte der Aufsichtsrat eingehend den Status und die Entwicklung der bei der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. angesiedelten Produktlinien UV-Scanner und Laser-Stepper. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den bilanziellen Risiken für den Konzern und die SÜSS MicroTec AG.

Am 4. August 2016 fand die fünfte ordentliche Sitzung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 statt. Gegenstand der Sitzung waren unter anderem die aktuellen Geschäftszahlen des zweiten Quartals 2016 sowie der Ausblick für das Gesamtjahr 2016. In dieser Sitzung diskutierte der Aufsichtsrat erneut den Status der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. im Beisein des General Manager. Der Aufsichtsrat fasste Beschluss, die notwendigen Schritte zur Umwandlung der SÜSS MicroTec AG in die SÜSS MicroTec SE einzuleiten. Zudem wurde über die anstehende Wahl des Aufsichtsrats im Rahmen der Hauptversammlung 2017 gesprochen. Im Anschluss stellte der Vorstand das Konzept für die Renovierung und den Umbau des Reinraums Sternenfels vor. Im Rahmen dieser Aufsichtsratssitzung stellte der Vorstand zudem die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung und eine aktuelle Wettbewerbsanalyse vor.

Am 22. August 2016 fasste der Aufsichtsrat Beschluss über eine Freistellung von Herrn Dr. Per-Ove Hansson, nachdem dieser am 16. August 2016 sein Amt als Vorstand und Vorstandsvorsitzender niedergelegt hatte.

In einer außerordentlichen Sitzung (per Telefon) am 30. August 2016 bestellte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Franz Richter zum neuen Vorstandsvorsitzenden der SÜSS MicroTec AG.

Am 8. November 2016 fand die sechste ordentliche Aufsichtsrats-sitzung statt. In dieser Sitzung berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf das Gesamtjahr 2016. Der Aufsichtsrat befasste sich erneut mit der Situation der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. sowie dem Stand einzelner, wichtiger Kundenprojekte. Schwerpunktthemen der Sitzung waren darüber hinaus die Zusammensetzung des Aufsichtsrats nach der Hauptversammlung 2017, eine mögliche Erweiterung sowie die Ausgestaltung der damit verbundenen Kandidatensuche. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit dem Status der geplanten Umwandlung der SÜSS MicroTec AG in die SÜSS MicroTec SE und billigte die Auftragserteilung für die in diesem Zusammenhang notwendige Reinvermögensprüfung an die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Darüber hinaus erörterte er die Prüfungsschwerpunkte für den Jahresabschluss 2016 und befasste sich mit der Aktualisierung der jährlichen Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex.

Gegenstand der letzten ordentlichen Sitzung des Geschäftsjahres 2016, die am 13. Dezember 2016 stattfand, waren die aktuelle Geschäftslage sowie die Planung für das Geschäftsjahr 2017. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Corporate Governance und dabei insbesondere mit der Finalisierung der aktualisierten Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex, den Zielen und Kriterien für die Besetzung des Aufsichtsrats sowie dem Fraud-Katalog der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Aufsichtsrat befasste sich mit dem Risikomanagement des Unternehmens und weiteren Vorstandsangelegenheiten. Es wurden zudem Themen wie die Erweiterung des Aufsichtsrats, Anforderungen an einen möglichen Kandidaten oder Kandidatin sowie der Status der Umwandlung der SÜSS MicroTec AG in die SÜSS MicroTec SE diskutiert.

Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Alle Aufsichtsratsmitglieder haben an sämtlichen Sitzungen und Beschlüssen teilgenommen.

| Aufsichtsratsmitglied | Sitzungs- teilnahme | Persönlich anwesend | Tele- fonische Teilnahme | Anwesen- heit |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| Dr. Stefan Reineck | 8/8 | 7 | 1 | 100% |
| Jan Teichert | 8/8 | 7 | 1 | 100% |
| Gerhard Pegam | 8/8 | 7 | 1 | 100% |

AUSSCHÜSSE

Ausschüsse hat der Aufsichtsrat aufgrund seiner Größe von drei Mitgliedern im Geschäftsjahr 2016 nicht gebildet.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat befasste sich im Geschäftsjahr 2016 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt Vergütungsbericht des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 80 ff. wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen im Januar 2016 die jährliche Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG und machten diese den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich.

In seiner Sitzung vom 10. Februar 2016 führte der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden. Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsrats-tätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln im Plenum mit Unterstützung von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen wären und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre, lagen im Geschäftsjahr 2016 nicht vor.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, hat den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2016 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2016 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315 a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 29. März 2017 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere gab er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns ab und stand dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen Jahres- und Konzernabschlussprüfung bildeten das interne Kontroll- und IT-System sowie unter anderem die Beurteilung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten in den Segmenten Lithografie und Bonder, die Umsatzrealisation und die Beurteilung möglicher Risiken aus Planabweichungen und Margenverlusten in einzelnen Produktsegmenten. Darüber hinaus wurden die rechnungslegungsrelevanten Themen des Scanner-Auftrags der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. und die Auswirkungen der Neuausrichtung des Vertriebs in Japan als Schwerpunkte der Prüfung behandelt. Außerdem gehörten die Vollständigkeit und Korrektheit der Anhangsangaben, die Vollständigkeit und Angemessenheit der Lageberichterstattung sowie das Thema Management Override zu den diesjährigen Prüfungsschwerpunkten. Im Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG bildeten darüber hinaus die Bewertung der Finanzanlagen sowie die Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen die Schwerpunkte der Prüfung.

Der Aufsichtsrat hat in der Bilanzsitzung am 29. März 2017 den Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht der SÜSS MicroTec AG jeweils für das Geschäftsjahr 2016 geprüft.

Der Aufsichtsrat hatte keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

BESETZUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im Geschäftsjahr 2016 gab es zwei personelle Änderungen im Vorstand. Herr Dr. Per-Ove Hansson legte sein Amt als Vorstand und Vorstandsvorsitzender am 16. August 2016 mit Wirkung zum Ablauf dieses Tages nieder. Der Aufsichtsrat berief am 30. August 2016 Herrn Dr. Franz Richter mit Wirkung zum 7. September 2016 für die Dauer von drei Jahren zum Vorstand und Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer) der SÜSS MicroTec AG. Daneben gehörten dem Vorstand im Geschäftsjahr 2016 weiterhin der Finanzvorstand Michael Knopp sowie der Produktionsvorstand Walter Braun an.

Der Aufsichtsrat blieb im Geschäftsjahr 2016 unverändert.

DANK

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung für die tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr aus.

Garching, 29. März 2017



Dr. Stefan Reineck, Aufsichtsratsvorsitzender

Menschen mit Visionen

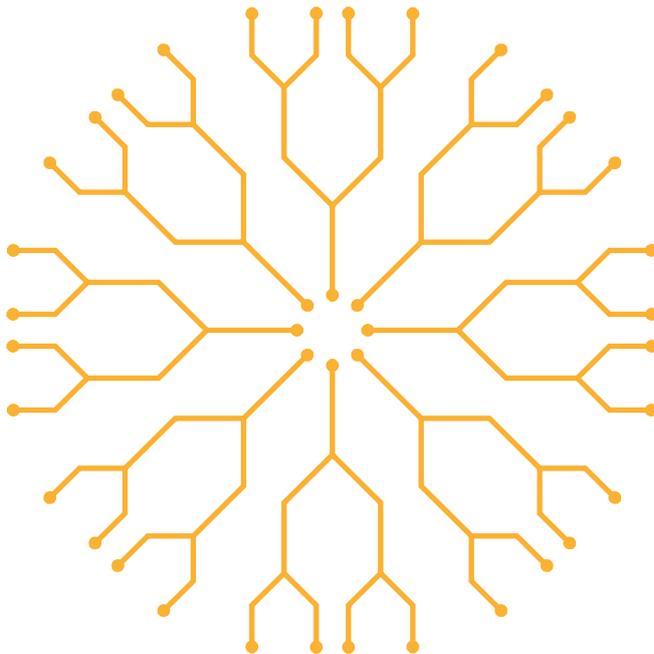




Was uns ausmacht: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Durch ihren Einsatz und ihr Engagement haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen entscheidenden Anteil am Unternehmenserfolg. Eine solide fachliche Ausbildung, vielfältige Interessen und individuelle Talente sind die Markenzeichen unserer Kolleginnen und Kollegen. Für uns ist es nicht nur wichtig, in allen Bereichen mit qualifiziertem Fachpersonal zu arbeiten, sondern auch, dass besonders unsere langjährigen Mitarbeiter ihr Wissen an junge Nachwuchskräfte weitergeben. Denn Ausbildung ist eine Investition in die Zukunft – in die Zukunft des Unternehmens und in die Zukunft junger Menschen.





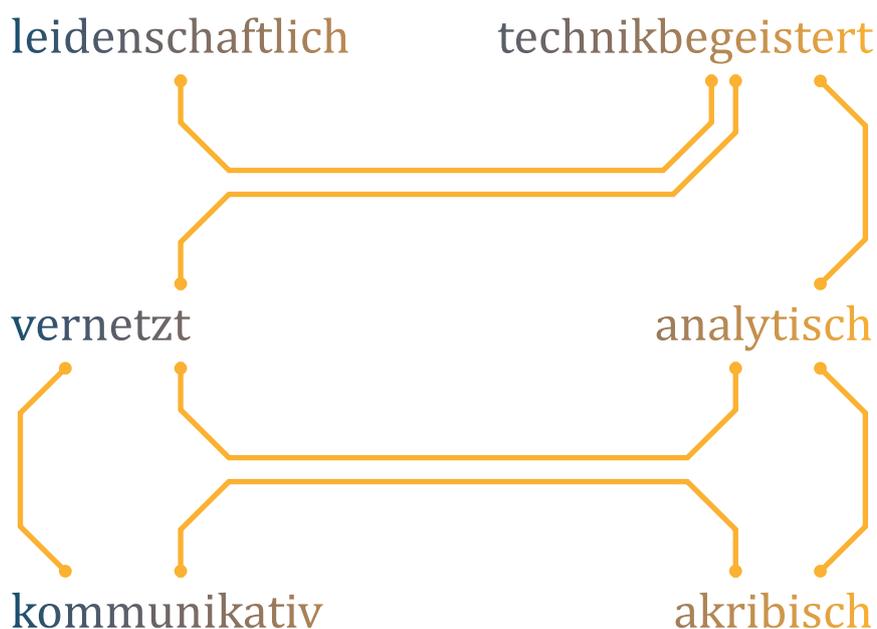
711 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrer Überzeugung und Leidenschaft, ihrer Begeisterung und ihren Visionen zum Erfolg von SÜSS MicroTec beitragen.

Unsere vielfältig zusammengesetzte Belegschaft, die mit ihrer Offenheit und Innovationsfreude die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sicherstellt, ist der Grundpfeiler von SÜSS MicroTec. Nur dank dem vielfältigen Know-how und Können der Belegschaft gelingt es uns, unsere innovativen Produkte und Lösungen am hart umkämpften Halbleitermarkt erfolgreich anzubieten. Eigene Ideen erfolgreich verwirklicht zu sehen ist für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein immenser Ansporn für Spitzenleistungen. Uns liegt zudem die Stärkung und Förderung der individuellen Interessen und Talente besonders am Herzen. Dies schafft einen starken Ansporn, Außerordentliches zu leisten.

Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Talente: Bei SÜSS MicroTec ist nicht nur Qualifikation maßgebend, sondern auch Kreativität, Querdenken und Experimentierfreude.



Zusammenspiel der Kräfte — Bei SÜSS MicroTec kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verschiedenen Eigenschaften, Fähigkeiten und Talenten zusammen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten ist ein wichtiger Baustein für den langfristigen Unternehmenserfolg. Wir sind der festen Überzeugung, dass die große Vielfalt in der Belegschaft im Unternehmen die Effektivität, Innovationsfähigkeit und Kreativität fördert. So muss sich der technikbegeisterte Entwicklungsingenieur beispielsweise in den verschiedenen Projektphasen mit dem F&E-Controller zusammensetzen, um die Vorgehensweise zu definieren, das Projekt zu budgetieren und abzubilden. In gleicher Weise müssen sich diese beiden mit dem gut vernetzten Leiter des Product-Centers abstimmen, um einen optimalen Produktionsablauf zu gewährleisten. In der Buchhaltung werden die Geschäftsprozesse, wie zum Beispiel die Umsatzlegung der kommunikativen Vertriebsmitarbeiterin, akribisch abgebildet und dokumentiert.





Das Segment Fotomaschinen-Equipment ist der einzige Geschäftsbereich bei SÜSS MicroTec, der mit seinen Produkten und Lösungen direkt das Frontend der Halbleiterfertigung adressiert. Dr. Martin Samayoa und seine Teamkollegen beschäftigen sich zielstrebig und leidenschaftlich mit der Entwicklung, der Konstruktion und der Herstellung von Geräten zur Reinigung von Fotomaschinen, die im Frontend der Halbleiterfertigung eingesetzt werden. Außerdem gehören zu ihrem Aufgabengebiet Lösungen für nachgelagerte bzw. angrenzende Prozessschritte, wie beispielsweise „bake and develop“.

„Bei SÜSS MicroTec kann ich meine Fähigkeiten und meine Erfahrung einsetzen, um innovative Technologien zu entwickeln, die die Herausforderungen in der Halbleiterindustrie adressieren. Es ist unsere Mission, technologisch führende Produkte zu entwickeln, die dem Kunden in dieser schnelllebigen und dynamischen Industrie einen erheblichen Mehrwert bieten.“

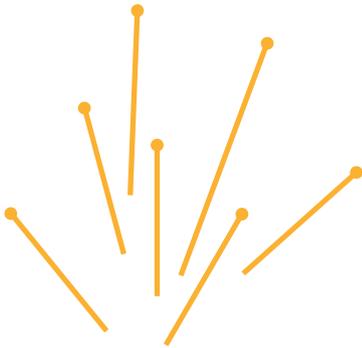
DR. MARTIN SAMAYOA



DR. MARTIN SAMAYOA ————— ist Entwicklungsingenieur bei der SUSS MicroTec Inc. in Corona, USA. In dieser Rolle ist er verantwortlich für führende Produktentwicklungsprojekte im Bereich Fotomaschinen-Equipment. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der Purdue University sowie einen Master-Abschluss im Bereich Systems Engineering der Penn State University. Seinen Dokortitel (PhD) hat er an der North Carolina State University erworben. Martin Samayoa, geboren und aufgewachsen in Guatemala City, Guatemala, zog in die USA, um eine Karriere im Bereich Forschung und Entwicklung zu verfolgen.

Das Segment Fotomaschinen-Equipment ist der einzige Geschäftsbereich bei SÜSS MicroTec, der mit seinen Produkten und Lösungen direkt das Frontend der Halbleiterfertigung adressiert. Dr. Martin Samayoa und seine Teamkollegen beschäftigen sich zielstrebig und leidenschaftlich mit der Entwicklung, der Konstruktion und der Herstellung von Geräten zur Reinigung von Fotomaschinen, die im Frontend der Halbleiterfertigung eingesetzt werden. Außerdem gehören zu ihrem Aufgabengebiet Lösungen für nachgelagerte bzw. angrenzende Prozessschritte, wie beispielsweise „bake and develop“.

leidenschaftlich





Fotomasken-Equipment (Mask Track Pro)

HIGHTECH FÜR DAS FRONTEND ——— SÜSS MicroTec ist Marktführer bei der Herstellung und Vermarktung von Geräten zur Reinigung von Fotomasken. Diese technologisch extrem anspruchsvollen Maschinen werden weltweit von unseren Kunden in der Halbleiterindustrie eingesetzt.

Im Fokus der Entwicklungsaktivitäten des Segments Fotomasken-Equipment liegen Technologien und Lösungen für die 193-nm-Immersion-Lithografie (193i), die neuartige Extrem-Ultraviolett-Lithografie (EUVL) sowie die Nano-Imprint-Lithografie (NIL). Dieser Geschäftsbereich unterliegt im unternehmensweiten Vergleich wahrscheinlich den stärksten Zyklen, da die Endkunden im Frontend der Halbleiterindustrie tätig sind und der wesentliche Geschäftstreiber das Voranschreiten von Moore's Law ist. Hier werden circa alle 18 Monate kleinere und leistungsfähigere Chipgenerationen entwickelt und gefertigt. Dazu sind regelmäßig neue Fotomasken und damit auch entsprechende Maschinen und Prozesse zum Reinigen dieser Masken notwendig.

Eine große Herausforderung ist die gründliche, aber dennoch schonende Reinigung der Fotomaske, die mit winzigsten Strukturen ausgestattet ist. Gerade die neuartige EUV-Lithografie stellt die Industrie vor große Herausforderungen. Hier kommen besondere, durch ein Pellicle geschützte Masken zum Einsatz. Im Jahr 2016 lag ein Entwicklungsschwerpunkt auf dem Design einer speziellen Halterung, die es ermöglicht, dass das Pellicle während des Rückseitenreinigungsprozesses auf der Fotomaske verbleibt, aber dennoch weder beschädigt noch kontaminiert wird. Ein Prototyp dieser Halterung stand zum Ende des Geschäftsjahres 2016 zur Verfügung und wird seit Anfang 2017 bei einem Kunden evaluiert.

Der Preis für eine einzelne Maske kann unter Umständen bei mehr als 100.000 Euro liegen. Daher ist der Einsatz einer adäquaten Reinigungstechnologie äußerst wichtig. Für SÜSS MicroTec bedeutet dies, immer bessere und verträglichere Reinigungsprozesse zu entwickeln, denn ein Defekt auf der Fotomaske würde im Produktionsprozess tausendfach repliziert und zu vielen fehlerhaften Mikrochips führen.

Der Bereich Fotomasken-Equipment umfasst Reinigungsplattformen für jede Strukturgröße in der Halbleiterindustrie. Gleichzeitig ist SÜSS MicroTec der weltweit einzige Anbieter von Maschinen zur Reinigung von EUVL-Fotomasken. Um bestmögliche Lösungen zu bieten, verfolgt der Bereich Fotomasken-Equipment einen extrem kundenorientierten Ansatz, insbesondere bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Die Aufgabenstellung besteht darin, technologiegetriebene Produkte und Lösungen zu entwickeln, die dem Kunden in der schnelllebigen und dynamischen Halbleiterindustrie einen technologischen oder monetären Vorteil bieten. Der Bereich Fotomasken-Equipment steuert seit der Akquisition im Jahr 2010 stabile Umsätze und gute Ergebnisse bei.

Ein weiterer Produktbereich im Segment Fotomasken-Equipment ist das sogenannte „bake and develop“. Um diesen Bereich weiterzuentwickeln, ist SÜSS MicroTec im Jahr 2015 eine Partnerschaft mit NuFlare Technology, Japan, eingegangen. NuFlare ist Marktführer bei Electron-Beam-Maskenschreibern und unterstützt damit die voranschreitende Strukturverkleinerung im Frontend.



Um kontinuierlich neue und innovative Produkte und Verfahren anbieten zu können, investiert SÜSS MicroTec Jahr für Jahr in Forschung und Entwicklung (F&E). Diese Prozesse werden über eine zielorientierte Planung, Steuerung und ein bedarfsgerechtes Berichtswesen abgebildet. Hierfür ist unter anderem der Bereich F&E-Controlling zuständig. Er schafft die Voraussetzung für faktenbasierte Entscheidungen, begleitet die Realisierung der langfristigen Unternehmensziele und verifiziert beziehungsweise steuert die Planung sowie Durchführung von F&E-Projekten hinsichtlich Zeitdauer, Kosten und Qualität.

„Die Symbiose aus Beruf und Berufung! Das ist es, was ich bei SÜSS MicroTec gefunden habe und sehr schätze. Ausbildung und Berufserfahrung zählen einerseits – Talent und Leistungsbereitschaft andererseits. Im Forschungs- und Entwicklungs-Controlling kann ich meine Vorliebe für analytisches Arbeiten sowie die enge Zusammenarbeit mit Kollegen aus technischen Fachbereichen gezielt zur Fortschreibung der Erfolgsgeschichte des Unternehmens einsetzen.“

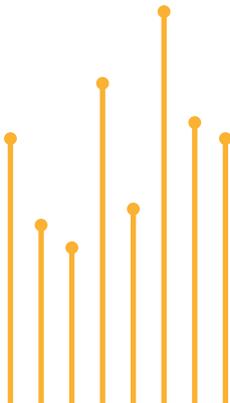
THOMAS RASEM



THOMAS RASEM ————— lebt in Mannheim, ist verheiratet und hat eine achtjährige Tochter. Er arbeitet seit Ende 2010 bei der SUSS MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels. Sein Studium zum Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Controlling/Betriebsorganisation hat er in Berlin absolviert. Bei uns ist er – seiner Begabung und seinen Interessen entsprechend – im Controlling für den Bereich Forschung und Entwicklung (F&E) zuständig. Seine Auswertungen und Analysen unterstützen F&E-Ingenieure und Geschäftsleitung im Tagesgeschäft sowie bei der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung von SÜSS MicroTec.

Um kontinuierlich neue und innovative Produkte und Verfahren anbieten zu können, investiert SÜSS MicroTec Jahr für Jahr in Forschung und Entwicklung (F&E). Diese Prozesse werden über eine zielorientierte Planung, Steuerung und ein bedarfsgerechtes Berichtswesen abgebildet. Hierfür ist unter anderem der Bereich F&E-Controlling zuständig. Er schafft die Voraussetzung für faktenbasierte Entscheidungen, begleitet die Realisierung der langfristigen Unternehmensziele und verifiziert beziehungsweise steuert die Planung sowie Durchführung von F&E-Projekten hinsichtlich Zeitdauer, Kosten und Qualität.

analytisch





LED Lampenhaus für Mask-Aligner (oben rechts),
Der Bonder XBS200 (oben links)

PRODUKTINNOVATIONEN — Mit dem umweltfreundlichen LED-Lampenhaus für Mask-Aligner und der XBS200 wurden im Geschäftsjahr 2016 zwei innovative und spannende Neuentwicklungen in den Bereichen Belichtung und permanentes Bonden in den Markt eingeführt. Die Produktlinien sind an den Standorten Garching und Sternenfels angesiedelt.

Schneller, schlanker, leistungsfähiger – maßgeschneiderte Lösungen für Kunden sind die Basis des langjährigen Geschäftserfolgs von SÜSS MicroTec. Um in der von Fortschritt und Innovation geprägten Halbleiterbranche und deren anverwandten Märkten weiterhin erfolgreich sein und wachsen zu können, weitet SÜSS MicroTec laufend seine Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung aus. Neben starken Entwicklungsaktivitäten und einer regen Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen und Universitäten werden alle Prozesse auf höchstmögliche Entwicklungsgeschwindigkeit und -effizienz ausgerichtet.

Wichtige Bausteine hierbei sind die Planung, Budgetierung und Überwachung der Entwicklungsprojekte. Bei SÜSS MicroTec gliedert sich ein solches Projekt in sechs Phasen wie in der unten stehenden Übersicht dargestellt. In die einzelnen Projektphasen ist das F&E-Controlling grundsätzlich involviert. Das Projektreporting, die Projektverwaltung und die Ermittlung der Material- und Personalkosten – beispielsweise die Kalkulation der benötigten Arbeitsstunden – obliegen den Fachkollegen im Controlling. Am Beispiel der 2016 neu entwickelten Bonder-Plattform XBS200 lässt sich der Entwicklungsprozess wie folgt darstellen:

SÜSS MicroTec hat im Jahr 2013 die Fertigung der seinerzeit defizitären Sparte automatischer, permanenter Bondsysteme eingestellt. Parallel wurde durch Markt- und Wettbewerbsanalysen festgestellt, dass auch zukünftig großer Bedarf für automatische Bonder besteht und der Markt attraktive Wachstumschancen bietet. Daraus resultierte die Entscheidung, das Produkt komplett neu zu entwickeln, um den Kunden zukünftig eine kostengünstige und technologisch anspruchsvolle Lösung zu bieten (Phase 1).

Anschließend haben Produktmanager und -spezialisten in enger Abstimmung mit dem F&E-Controlling evaluiert, ob und in welcher Form eine Neuentwicklung im Rahmen des finanziellen Budgets und der Zeitvorgaben möglich ist. Zudem wurden die Erkenntnisse aus Marktanalysen und Kundengesprächen genutzt, um zu definieren, welche technologischen Anforderungen und Funktionen die neue Maschine zu erfüllen hat und ob diese darstellbar sind (Phase 2).

In einem nächsten Schritt wurde exakt festgelegt, welche Spezifikationen die XBS200 etwa im Hinblick auf die Maschinengröße (Footprint), die zu bearbeitende Substratgröße, die Justagegenauigkeit und -wiederholbarkeit sowie den Einsatz von Überwachungssystemen erhalten soll. Ein detaillierter Projektplan inklusive Budgetvorgaben und Meilensteinen wurde in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und dem F&E-Controlling erstellt (Phase 3).

Konzeption und Entwicklung der Maschine selbst sowie der dazugehörigen Software wurden anhand der Projektvorgaben innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise die Erstellung von Teilelisten, die Konstruktionsplanung sowie die Entwicklung der einzelnen Module und Baugruppen. Am Ende des Designprozesses wies die XBS200 viele Neuerungen auf (Phase 4).

Nach Abschluss der Entwicklungsphase folgte zeitnah die Fertigung eines produktionsbereiten Prototyps in der Konstruktion. Zudem wurden Baupläne und Dokumentationen zur XBS200 erstellt und archiviert (Phase 5).

Die XBS200 wurde im März 2017 in den Markt eingeführt. Der Vertrieb, die Key-Account- und die Produktmanager sind nun gefragt, unseren Kunden weltweit diesen neuartigen und extrem wettbewerbsfähigen automatischen Bonder vorzustellen und diesen zu vermarkten. Die wichtigsten Anwendungsgebiete der XBS200 sind die Herstellung von Sensoren (MEMS) und die LED-Fertigung sowie die 3D-Integration. Sobald entsprechende Kundenaufträge vorliegen, wird die Fertigung der XBS200 auf Serienproduktion umgestellt (Phase 6).

| | |
|-----------------------------------|---|
| Startphase | Marktanalyse, Definition der Projektziele |
| Machbarkeitsanalyse | im Hinblick auf Technologie, Finanzierung, Timing; Detailplanung der Projektziele |
| Konzeption und Planung | Definition der Produktspezifikationen und Erstellung eines Projektplans |
| Design | von Hard- und Software der angestrebten Produktentwicklung |
| Umsetzung | Erstellung eines Maschinenprototyps, Dokumentation, ggf. Patentanmeldungen |
| Übertragung auf Volumenproduktion | Produktion auf die Volumenfertigung umstellen, Projektanalyse |



Die Anforderungen unserer asiatischen Produktionskunden im Hinblick auf Qualität, Durchsatz und Ausbeute der Maschinen sowie ihr Anspruch an Perfektion und Serviceleistungen von SÜSS MicroTec sind enorm. Gleichzeitig wird jedoch eine attraktive Preisgestaltung erwartet. Am Standort Hsinchu in Taiwan arbeiten zahlreiche Service- und Applikationsingenieure, die den Kunden eine Erreichbarkeit von 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche gewährleisten.

„Was ich am meisten an der Arbeit bei SÜSS MicroTec in Taiwan schätze, ist die ethische Firmenkultur sowie die freundliche und respektvolle Arbeitsumgebung. Ich habe eine besondere Vorliebe für Präzision. Ich bin nicht nur verantwortlich für die Buchhaltung, Finanzen und Controlling, sondern auch für das IT-Management. Damit bin ich jederzeit in der Lage, dem Management einen umfassenden und präzisen Überblick über die Gesamtsituation des Unternehmens an unserem Standort zu geben.“

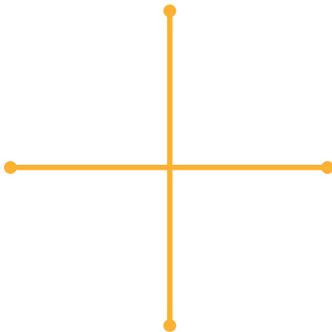
SARA HU

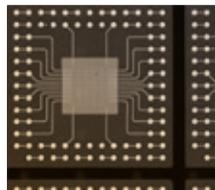
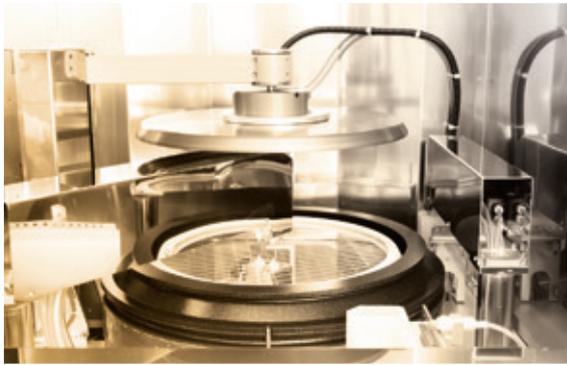
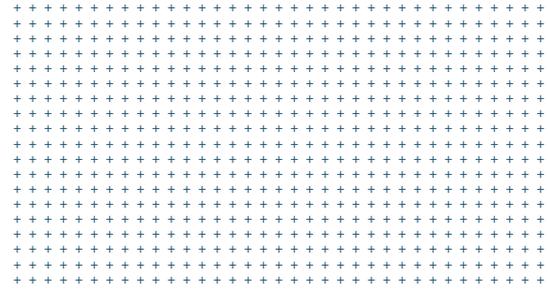


SARA HU ————— ist seit 2010 für SÜSS MicroTec in Taiwan tätig. Ihr Verantwortungsbereich erstreckt sich weit über den Bereich Rechnungswesen und Finanzen hinaus. Neben allen relevanten Themen im Zusammenhang mit dem Controlling ist sie zudem für das IT-Management zuständig. Bevor sie zu uns kam, arbeitete sie für verschiedene Firmen, darunter eine internationale CPA (Certified Public Accountant) Firma.

Die Anforderungen unserer asiatischen Produktionskunden im Hinblick auf Qualität, Durchsatz und Ausbeute der Maschinen sowie ihr Anspruch an Perfektion und Serviceleistungen von SÜSS MicroTec sind enorm. Gleichzeitig wird jedoch eine attraktive Preisgestaltung erwartet. Am Standort Hsinchu in Taiwan arbeiten zahlreiche Service- und Applikationsingenieure, die den Kunden eine Erreichbarkeit von 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche gewährleisten.

akribisch





ACS300 Gen3 (oben),
Fan-out-Wafer-Level-Packaging-Anwendung (rechts)
(Quelle: Fraunhofer IZM, Berlin)

GRÖSSTER ABSATZMARKT ASIEN ——— Deutlich mehr als die Hälfte des Unternehmensumsatzes mit SÜSS MicroTec-Produkten und -Lösungen wird derzeit hier erwirtschaftet. Dabei spielen Länder wie Taiwan, Korea und China eine bedeutende Rolle. In Taiwan zum Beispiel ist die weltweit größte Anzahl an Foundries (Auftragsfertigern) und OSATs (Outsourced Assembly- and Test-Houses) ansässig. Diese beiden Unternehmensgruppen stellen zusammen mit den IDMs (Integrated-Device-Manufacturers) wichtige Kundengruppen für SÜSS MicroTec dar.

Bereits im Geschäftsjahr 2015 war es SÜSS MicroTec gelungen, mehrere spannende Aufträge von einem asiatischen Halbleiterunternehmen zu gewinnen. Ein Teil dieser Aufträge betraf neuartige UV-Projektionsscanner, die am Standort Corona, USA, gefertigt werden. Zudem wurden mehrere Belacker und Entwickler durch diesen Kunden in Auftrag gegeben. Im Geschäftsjahr 2016 wurden all diese Maschinen fertiggestellt, an den Kunden ausgeliefert und installiert. Wie später in diesem Geschäftsbericht beschrieben, stellte uns die zeitgerechte Herstellung dieser Maschinen vor große Herausforderungen, da wir kurzfristig einen sehr hohen Auftragseingang abarbeiten mussten. Durch gezielte Vorfertigung, Outsourcing und viele Überstunden wurde diese Aufgabe von unseren Mitarbeitern hervorragend erfüllt.

Die Installation, die Inbetriebnahme sowie die Optimierung der Prozesse lagen nun in der Verantwortung der Service-, Software- und Applikationsingenieure in Asien. Es ist uns gelungen, die komplexen Prozessabläufe entsprechend den besonderen Kundenanforderungen zu optimieren, die Endabnahme im vierten Quartal 2016 abzuschließen und somit den Umsatz zu realisieren. Ein wichtiger Einsatzbereich für die installierten Geräte ist das Fan-out-Wafer-Level-Packaging, ein dynamisch wachsender Bereich im Halbleiter-Mid- und -Backend. Marktforschungsunternehmen gehen für die kommenden Jahre in diesem Bereich von einem deutlichen Umsatzwachstum, getrieben durch mobile Kommunikation und Vernetzung, aus.

Nicht nur die Herstellung der Chips bzw. Mikrochips, sondern auch die Strukturierung und das Packaging dieser Chips im Halbleiter-Mid- und -Backend werden immer aufwendiger und komplexer. Aus diesem Grund müssen auch hier stets neue Fertigungstechnologien entwickelt werden, wie beispielsweise das Fan-out-Wafer-Level-Packaging. SÜSS MicroTec leistet insbesondere mit seinen Lithografiegeräten – den UV-Projektionsscannern sowie den Belackern und Entwicklern – einen wesentlichen Beitrag, die Herausforderungen moderner Herstellungsverfahren zu meistern. Ein wichtiger Faktor hierbei ist die erreichbare Strukturgröße bei der Belichtung im Mikrometerbereich, denn auch im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie schreitet die Miniaturisierung, angelehnt an Moore's Law, stetig voran. Darüber hinaus sind beispielsweise der Ausgleich von Verformungen des Wafers vor dem Belichten oder das Verhindern von elektrostatischer Aufladung des Wafers wichtige Kriterien bei der Entscheidung für Produktionsmaschinen von SÜSS MicroTec.

SÜSS MicroTec konnte in den letzten Jahren verschiedene Aufträge bedeutender Halbleiterhersteller in diesem Bereich gewinnen und hat damit einmal mehr die technologische Leistungsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens unter Beweis gestellt.



Das Product-Center am Standort Sternenfels ist die Nahtstelle zwischen dem weltweiten Vertrieb, den Endkunden auf der einen Seite sowie der Fertigung mit Engineering, Supply-Chain und Operations auf der anderen Seite. Die Position von Heinz Hocke ist die Leitstelle zwischen vielen Fachbereichen innerhalb von SÜSS MicroTec und den Endkunden. Das Product-Center am Standort Sternenfels umfasst die Bereiche Fotomaschinen-Equipment, Bonder sowie die Produktlinien Belacker und Entwickler.

„Im Geschäftsjahr 2016 hat uns die hohe Auslastung der Produktion vor enorme Herausforderungen gestellt. Mein Interesse und meine jahrelange Erfahrung bei SÜSS MicroTec haben mir geholfen, die verschiedenen Fachabteilungen wie ein Dirigent zu einer harmonischen Einheit zu vernetzen und somit meinen Teil zur erfolgreichen Bewältigung dieser Mammutaufgabe beizutragen.“

HEINZ HOCKE



HEINZ HOCKE ————— arbeitet seit 28 Jahren bei der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG in Sternenfels. Er hat die Fachschule für Elektrotechnik in Pforzheim absolviert, ist staatlich geprüfter Elektrotechniker und verantwortet am Standort Sternenfels das Product-Center. In diesem Bereich ist er mit seinem 50 Mitarbeiter starken Team dafür verantwortlich, dass alle Kundenaufträge des Standorts Sternenfels vom Auftragseingang bis zur Endabnahme beim Kunden konstruiert, geplant und überwacht werden, damit sie in „time and quality“ fristgerecht fertiggestellt werden.

Das Product-Center am Standort Sternenfels ist die Nahtstelle zwischen dem weltweiten Vertrieb, den Endkunden auf der einen Seite sowie der Fertigung mit Engineering, Supply-Chain und Operations auf der anderen Seite. Die Position von Heinz Hocke ist die Leitstelle zwischen vielen Fachbereichen innerhalb von SÜSS MicroTec und den Endkunden. Das Product-Center am Standort Sternenfels umfasst die Bereiche Fotomaschinen-Equipment, Bonder sowie die Produktlinien Belacker und Entwickler.

vernetzt





Blick in den Reinraum in Sternenfels (unten)

VOLLAUSLASTUNG IN DER PRODUKTION ——— Im Geschäftsjahr 2016

herrschte an allen Produktionsstandorten eine hohe Kapazitätsauslastung. Insbesondere das Segment Lithografie wies unterjährig einen enorm hohen Auftragsbestand aus.

Der Produktionsstandort Sternenfels liegt im Kraichgau, in Baden-Württemberg, inmitten von Weinbergen und dennoch nahe den Industriezentren Stuttgart, Heilbronn und Karlsruhe. Dies ermöglicht Sternenfels eine unmittelbare Nähe zu den Fachhochschulen in Pforzheim und Karlsruhe, was für die Gewinnung von Nachwuchskräften von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kampf um gut qualifizierte Nachwuchskräfte mit Zulieferern der Automobilindustrie bietet das Unternehmen insbesondere attraktive Arbeitsbedingungen für Menschen, die sich in Unternehmensstrukturen wohlfühlen, die von kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien gekennzeichnet sind. Am Standort Sternenfels findet man zudem eine internationale Belegschaft, bei der sich Englisch in vielen Bereichen zur Standardsprache im täglichen Umgang miteinander entwickelt hat. Dies ist für einige Berufseinsteiger sicherlich ein weiteres, wichtiges Kriterium bei der Berufs- und Arbeitgeberwahl.

Im vergangenen Geschäftsjahr lag die große Herausforderung am Standort Sternenfels im hohen Auftragsbestand, der zu einem nicht unerheblichen Anteil aus dem Rekordauftragseingang im vierten Quartal 2015 resultierte. Die Kunden platzierten Orders mit teilweise großen Stückzahlen, die innerhalb möglichst kurzer Lieferzeiten bei gleichzeitig hohem Qualitätsanspruch ausgeführt werden mussten. Insbesondere das Segment Lithografie verzeichnete zum Jahresende 2015 prall gefüllte Auftragsbücher. Belacker und Entwickler, aber auch Mask-Aligner, die am Standort Garching bei München gefertigt werden, sowie Geräte zur Reinigung von Fotomasken wurden extrem stark nachgefragt.

Der Auftragsbestand zum Jahresende 2015 führte im Geschäftsjahr 2016 zu einer enorm hohen Auslastung im Produktionsumfeld am Standort Sternenfels. Eine große Herausforderung lag beispielsweise in der Koordination der Bereiche Beschaffung, Produktion und Software-Engineering. Im zurückliegenden Geschäftsjahr wurde aufgrund der hohen Auslastung erstmals die Fertigung ganzer Maschinen inklusive Inbetriebnahme sowie Lieferung an externe Partner in Deutschland vergeben. Ein Beispiel hierfür war die Fertigung der ACS200 Gen3, der dritten Generation des 200-mm-Produktionsbelackers und -entwicklers.

Ein wesentlicher Treiber der Nachfrage nach SÜSS MicroTec-Maschinen waren umfangreiche Investitionen eines großen asiatischen Kunden in die sogenannte Fan-out-Wafer-Level-Packaging-Technologie. Hier konnte SÜSS MicroTec besonders mit seinen Lithografieprodukten und -lösungen überzeugen und spannende Aufträge gewinnen. Im Jahresverlauf 2016 wurden die Aufträge des Auftragsbestands zum Jahreswechsel 2015/16 abgearbeitet und die Maschinen konnten in den Umsatz gebracht werden.

Zur Verbesserung der Überwachung der Kostenentwicklung bei einzelnen Projekten wurde im Geschäftsjahr 2016 am Standort Sternenfels darüber hinaus eine neue Projektstruktur in das SAP-System eingeführt.



SÜSS MicroTec generierte in den vergangenen Jahren jeweils rund 25 Prozent seines Umsatzes in der Region EMEA, obwohl der europäische Halbleiter- und Halbleiter-Equipment-Markt über die letzten Jahrzehnte im globalen Wettbewerb Marktanteile gegenüber Asien verloren hat. Außerdem haben sich die Halbleitertechnologien und -produkte für den Automobilbereich gut entwickelt. Hierzu gehören beispielsweise die Herstellung einer Vielzahl von MEMS-Sensoren und Bauelemente für den Infotainment-Bereich. Zudem ist der Markt für Power Devices in Europa sehr attraktiv.

„Im Vertrieb bei SÜSS MicroTec schätze ich den engen Kontakt mit meinen Kunden sowie die Internationalität meiner Arbeit. Meine Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich, und ich habe die Möglichkeit, die vielseitigen Einsatzbereiche und Anwendungsgebiete unserer Maschinen beim Kunden kennen zu lernen. Bei meiner Arbeit bin ich häufig die Schnittstelle zwischen Kunden auf der einen Seite und Applikations-, Produktions- sowie Entwicklungsingenieuren auf der anderen Seite.“

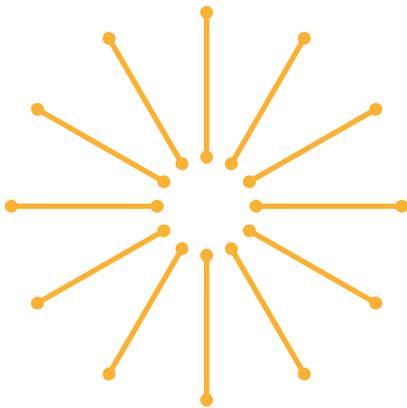
VIRGINIE QUET

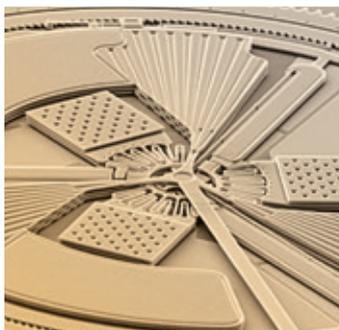


VIRGINIE QUET ————— ist 36 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Sie kam 2007 zu SÜSS MicroTec und arbeitet seither in Frankreich. Virginie Quet steht in engem Kontakt zu europäischen Kunden in Frankreich, Benelux und Italien sowie Israel. Als Account-Managerin ist sie zuständig für den Vertrieb der gesamten Produktpalette von SÜSS MicroTec. Nach Abschluss ihrer Ingenieursausbildung war sie zunächst in anderen Unternehmen als Ingenieurin im Bereich Forschung und Entwicklung sowie als Applikationsingenieurin im Bereich Optoelektronik tätig. Die hierbei erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten kann sie sehr gut im Kontakt mit den Kunden von SÜSS MicroTec einsetzen.

SÜSS MicroTec generierte in den vergangenen Jahren jeweils rund 25 Prozent seines Umsatzes in der Region EMEA, obwohl der europäische Halbleiter- und Halbleiter-Equipment-Markt über die letzten Jahrzehnte im globalen Wettbewerb Marktanteile gegenüber Asien verloren hat. Außerdem haben sich die Halbleitertechnologien und -produkte für den Automobilbereich gut entwickelt. Hierzu gehören beispielsweise die Herstellung einer Vielzahl von MEMS-Sensoren und Bauelemente für den Infotainment-Bereich. Zudem ist der Markt für Power Devices in Europa sehr attraktiv.

kommunikativ





Blick in den Reinraum in Garching (oben),
MEMS-Anwendung (unten)

WACHSTUMSMARKT SENSORIK ——— Allein in Europa hat SÜSS MicroTec weit mehr als 100 MEMS-Kunden. Insbesondere mit unseren Maschinen zum Belackern, Belichten und Entwickeln von Wafern sowie unseren manuellen Bondsystemen sind wir in diesem Marktsegment stark vertreten. Die Fertigung dieser Maschinen findet an unseren beiden Standorten in Deutschland statt.

SÜSS MicroTec vertreibt seine Produkte weltweit, fertigt seine Maschinen jedoch in Deutschland und in den USA. Schaut man sich die Kostenstruktur des Unternehmens genauer an, so wird deutlich, warum dies trotz internationalem Wettbewerb und Preisdruck nachhaltig möglich ist: Der Löwenanteil der ausgewiesenen Umsatzkosten wird für Material- und nicht für Personalkosten aufgewendet. Eine Verlagerung an Standorte mit vermeintlich geringeren Personalkosten hätte somit nur bedingt Einfluss auf unsere Kostenstruktur. Viel wichtiger sind in diesem Zusammenhang der geschickte Einkauf von Materialien und Teilen sowie flexible und leistungsstarke Zulieferunternehmen.

Zudem sind für den Unternehmenserfolg das Know-how und die Motivation unserer Mitarbeiter ausschlaggebend. Bei der Fertigung unserer Mask-Aligner können wir auf eine mehr als 50-jährige Tradition am Standort Garching zurückblicken. Das Wissen und die Erfahrung unserer langjährigen Mitarbeiter sind somit ein enorm wichtiger Baustein für den Geschäftserfolg dieser Produktlinie.

Unsere in Deutschland produzierten Maschinen finden in Europa häufig Einsatz im Bereich Forschung und Entwicklung sowie bei der Herstellung von MEMS-Sensoren, Microparts und Power-Devices. Wichtige Einsatzbereiche dieser Bauelemente sind die Automobilindustrie, die mobile Kommunikation, die Biotechnologie sowie der Bereich alternative Energien und zunehmend die Industrie 4.0 beziehungsweise das Internet der Dinge (IoT). Informationen müssen gesammelt, digitalisiert, gespeichert, übertragen und später analysiert werden. Egal in welchem Umfeld man sich bewegt, der erste Schritt ist die Informationsgewinnung, zum Beispiel durch Druck-, Temperatur- oder Bewegungs- und Lagesensoren (MEMS-Sensoren). Diese MEMS-Sensoren bilden eine abgeschlossene Einheit und werden durch Lithografieverfahren in der Halbleiterindustrie hergestellt. SÜSS MicroTec kommt in diesem Marktsegment insbesondere bei europäischen Kunden mit seinen Bondern, Belackern und Entwicklern sowie den Mask-Alignern zum Einsatz.

Der Sensorikmarkt entwickelt sich bereits seit einigen Jahren sehr dynamisch und weist zweistellige Wachstumszahlen auf. Aktuell kommen fast täglich neue Anwendungsfelder hinzu, die das Wachstum in diesem Bereich aufrechterhalten oder sogar beschleunigen. Anwendungsbereiche in der Medizintechnik oder im Haushalt finden derzeit nur in kleinem Umfang statt, werden aber zukünftig stark an Bedeutung gewinnen.

SÜSS MicroTec ist mit seinen Produkten und Lösungen hervorragend aufgestellt, um von den attraktiven Wachstumschancen auch im Bereich Sensorik zu profitieren.



Nachwuchsförderung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ob durch Schüler- oder Studentenpraktika, Ausbildung im technischen oder kaufmännischen Bereich oder durch enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten, SÜSS MicroTec beginnt schon früh, potenzielle Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen beziehungsweise zu fördern.

„Als Auszubildender zum Mechatroniker

lerne ich, elektrische, mechanische, pneu-

matische und hydraulische Komponenten

zu einem System zu vereinen.

Ich musste ein Jahr auf genau diesen Wunsch-

Ausbildungsplatz bei SÜSS MicroTec warten.

Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht

bereut habe. Hier kann ich meine Begeisterung

für Technik einsetzen, um zu lernen und zu

verstehen, wie Elektronik und Mechanik im

Halbleitermaschinenbau zusammenwirken.“

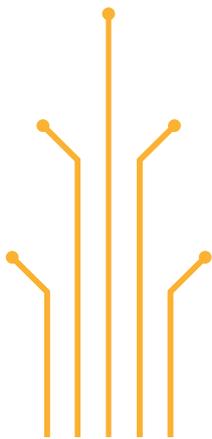
TIMO KAGERER



TIMO KAGERER ————— ist 19 Jahre alt, lebt in Neufahrn bei Freising und hat die Realschule in Eching absolviert. Er ist Auszubildender im zweiten Lehrjahr bei der SUSS MicroTec Lithography GmbH in Garching. Timo Kagerer hatte sich bereits im Jahr 2014 um einen Ausbildungsplatz zum Mechatroniker beworben. Leider waren damals alle Stellen schon besetzt. Ein Jahr später konnte er dann aber bei uns seine Ausbildung zum Mechatroniker beginnen. Er hat das „Wartejahr“ mit einem Nebenjob überbrückt und ist nun seit dem 1. September 2015 im Unternehmen beschäftigt.

Nachwuchsförderung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Ob durch Schüler- oder Studentenpraktika, Ausbildung im technischen oder kaufmännischen Bereich oder durch enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstituten, SÜSS MicroTec beginnt schon früh, potenzielle Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen beziehungsweise zu fördern.

technikbegeistert





AUSBILDUNG BEI SÜSS MICROTEC — Sie zeichnet sich aus durch projektorientiertes Lernen sowie eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Derzeit beschäftigt das Unternehmen an den beiden deutschen Standorten 30 Auszubildende.

Bei SÜSS MicroTec kann man technische und kaufmännische Ausbildungsberufe erlernen. Der am häufigsten nachgefragte Ausbildungsplatz ist der des Mechatronikers beziehungsweise der Mechatronikerin. Mechatroniker bauen Maschinen aus mechanischen und elektronischen Teilen, nehmen sie in Betrieb und geben Hinweise zur Bedienung. Während der dreieinhalbjährigen Ausbildung lernt man, mit verschiedensten technischen Systemen umzugehen, Maschinen zu warten, zu reparieren – und ist darüber hinaus an der Entwicklung technischer Innovationen beteiligt.

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist laut Bundesregierung für den Wirtschaftsstandort Deutschland unverzichtbar. Sie ist die Basis für Innovation und Wachstum. Im deutschen Modell des Ausbildungsberufs erlernt man in Theorie und Praxis gleichermaßen die Grundlagen seiner zukünftigen beruflichen Tätigkeit. Zudem ist eine abgeschlossene Ausbildung eine wesentliche Voraussetzung dafür, die Gefahr von Arbeitslosigkeit – und erst recht von Langzeitarbeitslosigkeit – so gering wie möglich zu halten.

Für SÜSS MicroTec sind neben Universitäts- und Fachhochschulabsolventen auch junge, motivierte Schulabgänger für Ausbildungsberufe wichtige Zielgruppen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. SÜSS MicroTec ist ein mittelständisch geprägtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und gleichzeitig globaler Ausrichtung. Es bietet seinen Auszubildenden die Chance, ein solides Handwerk zu erlernen und gegebenenfalls eine Festanstellung nach Ende der Ausbildung zu erhalten. Im Geschäftsjahr 2016 waren bei SÜSS MicroTec weltweit 68 Mitarbeiter im Verwaltungsbereich, 262 in Marketing und Vertrieb sowie 381 im Bereich Produktion und Technik tätig.

Gerade in der jetzigen Zeit des Fachkräftemangels stehen mittelständische Unternehmen wie SÜSS MicroTec im direkten Wettbewerb mit großen, internationalen Konzernen. Schulabgänger müssen sich also entscheiden, in welchem Umfeld sie ihren Beruf erlernen wollen. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein familiäres Miteinander der Kollegen sprechen eindeutig für SÜSS MicroTec. Die Auszubildenden werden Schritt für Schritt in den Arbeitsalltag eingebunden und an ihre neuen Aufgaben herangeführt. Je nach Ausbildungsberuf durchlaufen sie verschiedene Stationen und Fachbereiche und bekommen somit einen guten Einblick in die Organisationsstruktur und die Abläufe im Unternehmen. In technischen Ausbildungsberufen beginnt der Werdegang zunächst in der hauseigenen Lehrwerkstatt, wo der sorgfältige und fachgerechte Umgang mit Maschinen und Werkzeugen erlernt wird. Zudem versucht das Unternehmen, die Auszubildenden schon möglichst früh mit den Experten aus verschiedenen Fachbereichen zusammenzubringen. Timo Kagerer hat beispielsweise im letzten Jahr einen erfahrenen Servicemitarbeiter begleitet, als dieser einen Kunden in Irland besucht hat.

Das Unternehmen plant zukünftig neben der Ausbildung junger Mitarbeiter einen verstärkten Fokus auf die Fort- und Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter zu legen.

Investor Relations

Für viele Kapitalanleger war das Börsenjahr 2016 äußerst nervenaufreibend. Im Geschäftsjahr 2016 gab es anhaltende Konjunktursorgen in China, einen ungewöhnlich niedrigen Ölpreis und das überraschende Nein der Briten zur Europäischen Union – den Brexit. Darüber hinaus hat nicht zuletzt die Wahl des neuen US-Präsidenten immer wieder zu heftigen Kursturbulenzen und einer hohen Volatilität am Aktienmarkt geführt. In den ersten Monaten des Jahres 2016 fiel der Leitindex DAX deutlich unter 9.000 Zähler, konnte sich jedoch im Jahresverlauf wieder erholen. Zum Ende des vierten Quartals 2016 lag der DAX bei 11.481,06 Punkten und damit um 6,87 Prozent höher als zu Jahresbeginn 2016 (Eröffnungskurs 4. Januar 2016: 10.743,00 Punkte).

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE

Die SÜSS MicroTec-Aktie entwickelte sich im ersten Quartal 2016 sehr gut und konnte gegenüber dem Schlusskurs von 8,35 Euro am letzten Handelstag des Jahres 2015 um 6,6 Prozent auf 8,94 Euro zum Ende des ersten Quartals zulegen. Ein Grund hierfür war, dass SÜSS MicroTec für das vierte Quartal 2015 einen Rekordauftragszugang vermeldet hatte. Positiv auf die Kursentwicklung wirkte zudem die Mitteilung der Deutschen Börse, dass die Aktien von SÜSS MicroTec ab 21. März 2016 wieder im TecDAX, dem Technologieindex der Deutschen Börse, gelistet wurden.

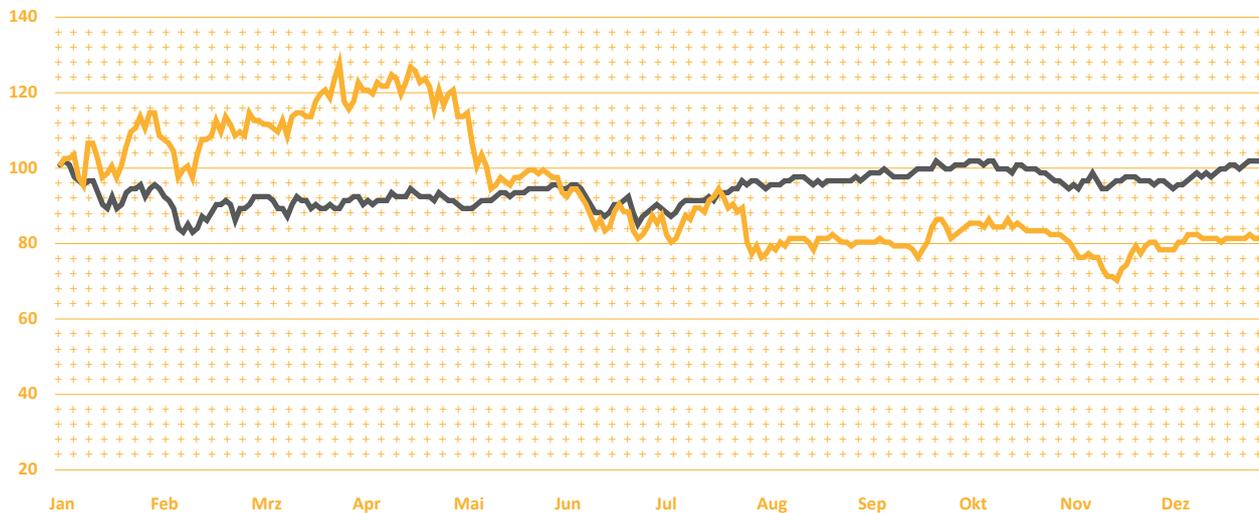
Im zweiten Quartal entwickelte sich der Aktienkurs zunächst weiter positiv. Mit Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal 2016 wurde die gute Kursentwicklung gestoppt. Trotz des positiven Ausblicks auf das zweite Quartal sowie auf das Gesamtjahr 2016 konnte sich die Aktie einem spürbaren Abwärtstrend nicht entziehen. Zum Ende des zweiten Quartals lag der Kurswert bei 6,77 Euro und damit 18,9 Prozent unter dem Wert zum Jahresende 2015. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch der Vergleichsindex TecDAX im gleichen Zeitraum um rund 13 Prozent gegenüber Jahresende 2015 gesunken ist.

Zum Ende des dritten Quartals 2016 ist die SÜSS MicroTec-Aktie aufgrund der Marktkapitalisierung aus dem TecDAX ausgeschieden. Die Aktienkursentwicklung im dritten Quartal verlief insgesamt sehr verhalten. Zum Quartalsende gab es eine leichte Kurserholung, so dass die Aktie das dritte Quartal mit einem Kurs von 6,51 Euro beendete. Der TecDAX konnte sich nach seiner Schwächephase im ersten Halbjahr wieder deutlich erholen und veränderte sich somit in Summe kaum. Für die SÜSS MicroTec-Aktie lag der Kursrückgang im gleichen Zeitraum bei rund 22 Prozent.

Das vierte Quartal 2016 war sehr stark von der anstehenden Wahl des US-Präsidenten geprägt. Spekulationen um einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump sowie die möglichen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen auf die restliche Welt wurden täglich aufs Neue heiß diskutiert. Bei der eigentlichen Wahl gewann Donald Trump tatsächlich mit deutlicher Mehrheit gegen die Demokratin Hillary Clinton. Das sich rasch abzeichnende Wahlergebnis führte am Morgen des Wahltags zu heftigen Turbulenzen am Aktienmarkt. Am gleichen Tag legte SÜSS MicroTec Zahlen zum dritten Quartal vor und hielt eine Telefonkonferenz ab. Der Aktienkurs reagierte im Vergleich zu vielen anderen Aktien kaum und schloss den Börsentag mit einem leichten Minus von rund einem Prozent ab. Im weiteren Verlauf des vierten Quartals bewegte sich die Aktie kurzzeitig in einem deutlichen Abwärtskanal, konnte diesen allerdings Mitte November wieder verlassen und pendelte seither in einer gewissen Bandbreite oberhalb der 6-Euro-Marke. Das Geschäftsjahr schloss die Aktie mit einem Kurs von 6,40 Euro ab, der TecDAX verzeichnete im Jahresvergleich ein Minus von 1,04 Prozent und beendete das Jahr mit 1.811,72 Punkten.

Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt an den deutschen Börsenplätzen XETRA und Frankfurt gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien lag im Geschäftsjahr 2016 bei rund 168 Tsd. Stück (2015: durchschnittlich rund 129 Tsd. Aktien pro Tag).

KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTEC-AKTIE IM JAHR 2016



XETRA-Schlusskurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 4. Januar 2016: 7,79 €

— SÜSS MicroTec AG, indiziert
 — TecDAX, indiziert

VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON SÜSS MICROTEC UND TECDAX IM GESCHÄFTSJAHR 2016

| | 30.12.2016 | 30.12.2015 | Veränderungen |
|----------------------|------------|------------|---------------|
| TecDAX (in Punkten) | 1.811,72 | 1.830,74 | -1,04% |
| SÜSS MicroTec (in €) | 6,40 | 8,35 | -23,3% |

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE IM ÜBERBLICK

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapierkennnummer | A1K023 |
| ISIN | DE000A1K0235 |
| Reuters-Kürzel | SMHN |
| Bloomberg-Kürzel | SMHN:GR |
| Börsensegment | Prime Standard |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31.12.2016) | 19.115.538 |
| Wertpapiergattung | Namensaktien |
| Designated Sponsor zum 31.12.2016 | equinet Bank AG |
| Beginn der Börsennotierung | 18.05.1999 |
| Jahresanfangs-/schlusskurs in € | 7,79€/6,40€ |
| Jahreshoch-/tief in € ¹ | 9,90€/5,47€ |

¹ Xetra-Schlusskurs.

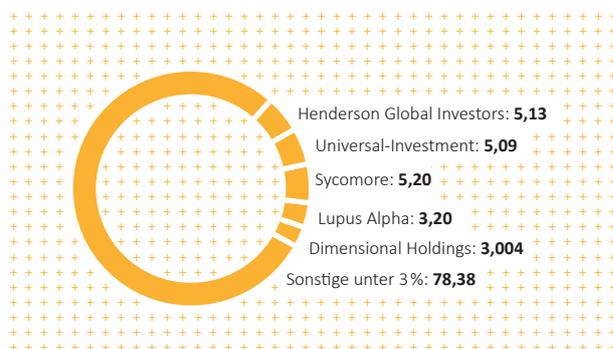
INVESTOR RELATIONS-AKTIVITÄTEN

Investor Relations umfasst alle Maßnahmen, die der Pflege der Beziehungen eines börsennotierten Unternehmens zu den Investoren dienen. Es geht bei der Investor Relations-Arbeit unter anderem darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informationen über das Unternehmen zu versorgen und somit eine angemessene Bewertung der Aktie an der Börse zu gewährleisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den direkten Ansprechpartnern gehören Privataktionäre, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhäusern und natürlich auch die Finanzpresse.

Vorstand und Investor Relations besuchten im Börsenjahr 2016 sechs Kapitalmarktkonferenzen und absolvierten mehrere Roadshows. Die Kapitalmarktkonferenzen fanden erneut in München, Frankfurt und Zürich statt. Zusätzlich dazu wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

Im Jahr 2016 gab es folgende Veränderungen in der Aktionärsstruktur: Baillie Gifford und die Internationale KAG (INKA) meldeten im Jahresverlauf einen Anteil von unter 3,0 Prozent. Neu dazugekommen sind Lupus Alpha mit einem gemeldeten Anteilsbesitz von 3,2 Prozent sowie Universal Investment mit einem Anteil von 5,09 Prozent zum Jahresende 2016. Im Geschäftsjahr 2016 stockte Sycomore seine Position von bisher 3,14 Prozent auf 5,20 Prozent auf. Auch die Dimensional Holding erhöhte den Anteilsbesitz leicht von 2,99 Prozent auf 3,004 Prozent. Der Streubesitz beträgt zum Jahresende 2016 weiterhin 100 Prozent.

AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2016 in %



ANALYSTENEMPFEHLUNGEN WEITERHIN POSITIV

Zum Jahresende 2016 wurde das Unternehmen von insgesamt acht Banken und Research-Häusern aktiv gecovered. Stand Dezember 2016 haben sechs von acht Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen, daneben gab ein Analyst die Empfehlung zum Halten der Aktie und ein Analyst stuft die Aktie neutral ein. Zum Jahresende gab es keine Verkaufsempfehlung. Eine Übersicht über die Research-Studien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter > www.suss.com > *Investor Relations*.

HAUPTVERSAMMLUNG

Am 15. Juni 2016 fand die ordentliche Hauptversammlung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Insgesamt waren über 80 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit waren 29,29 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Neben der Entscheidung über die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats wurde über die Bestellung des Abschlussprüfers abgestimmt. Die Aktionäre des Unternehmens gaben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung präsentierten. Zudem wurde das Vergütungssystem für den Vorstand von der Hauptversammlung gebilligt.

Der damalige Vorstandsvorsitzende Dr. Per-Ove Hansson erläuterte in seinem Bericht die wesentlichen Entwicklungen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015 sowie des ersten Quartals 2016 und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2016. Insbesondere ging er in seiner Rede auf wichtige Meilensteine und Produktneuerungen des Geschäftsjahres 2015 sowie die in der Hauptversammlung 2015 verkündeten Ziele und deren Zielerreichungsgrad im Juni 2016 ein.

Corporate Governance

Der Begriff Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Für SÜSS MicroTec gehören neben Transparenz eine offene Kommunikation mit Aktionären und Investoren sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand zu den wesentlichen Aspekten einer guten Corporate Governance. SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden Sie im nachfolgenden Bericht.

CORPORATE GOVERNANCE IM ÜBERBLICK

Mit der Zielsetzung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen, hat die Corporate Governance einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben sich im Geschäftsjahr 2016 erneut intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance*.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben am 9. Januar 2017 gem. § 161 Abs. 1 AktG folgende Entsprechenserklärung abgegeben:

Die SÜSS MicroTec AG hat den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2016 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen. Die SÜSS MicroTec AG wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit den nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen entsprechen:

SELBSTBEHALT BEI D&O-VERSICHERUNGEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 Abs. 3, bei Abschluss einer D&O-Versicherung (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

VERTIKALER VERGÜTUNGSVERGLEICH

In Ziffer 4.2.2 Abs. 2 Satz 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat, bei der Festlegung der Vorstandsvergütung das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises sowie der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist der Auffassung, dass die Festlegung des oberen Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann. Die SÜSS MicroTec AG erklärt daher insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung.

VERSORGUNGSZUSAGEN

Unter Ziffer 4.2.3 Abs. 3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat, bei Versorgungszusagen das jeweils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der Dauer der Vorstandszugehörigkeit – und den daraus abgeleiteten jährlichen sowie langfristigen Aufwand für das Unternehmen zu berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec weicht von dieser Empfehlung ab, da für die Vorstandsmitglieder kein bestimmtes „Versorgungsniveau“ im Ruhestand, sondern eine markt- und unternehmenskonforme Vergütung der aktiven Tätigkeit angestrebt wird. Unmittelbare Versorgungszusagen, bei denen die Gesellschaft selbst die zugesagten Leistungen erbringt, werden den Mitgliedern des Vorstands grundsätzlich nicht gewährt. Soweit die Gesellschaft den Vorstandsmitgliedern einen Zuschuss zur Altersvorsorge gewährt und Beiträge in eine Direktversicherung (Kapitallebens- bzw. Rentenversicherung) einzahlte, ist damit keine Zusage eines bestimmten Versorgungsniveaus verbunden.

BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

FESTLEGUNG EINER REGELGRENZE FÜR DIE ZUGEHÖRIGKEITSDAUER IM AUFSICHTSRAT

Entsprechend Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat festlegen. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG weicht von dieser Empfehlung ab, da die Festlegung einer Regelzugehörigkeitsgrenze den Handlungsspielraum sowie die Kompetenz des Aufsichtsrats gefährden könnte. Das unabhängige und verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec nicht durch die Begrenzung der Verweildauer im Aufsichtsrat gefördert. Im Gegenteil, durch die komplexe Produkt- und Unternehmensstruktur ist eine gewisse Verweildauer im Aufsichtsrat eher positiv zu sehen, da im Zeitverlauf wertvolle unternehmensspezifische Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die zum Wohl des Unternehmens eingesetzt werden können.

KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec verfolgt den Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren und dabei größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten. Dazu nutzt das Unternehmen neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten die Möglichkeit von Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows sowie die Website, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen viermal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter > www.suss.com > *Investor Relations* neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereitgestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei einsehen bzw. abrufen.

Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG können sich unsere Aktionäre mit Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. Wir bereiten die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der Abteilung Investor Relations angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, unseren Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können

vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SÜSS MicroTec dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – etwa Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt und es wurden keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2016 nicht. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2016 nicht auf.

ZIELE UND KRITERIEN DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER ZUSAMMENSETZUNG

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstands auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich. Darüber hinaus gewinnen dynamische Veränderungen in Markt, Technologie und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung, die weitere Kompetenzen zur Digitalisierung und Human Resources erfordern. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Netzwerke vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu gehören insbesondere Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inkl. Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarktkommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Aufsichtsratsmitglieder sollen neben den Fachkompetenzen über Methodenkompetenz zur Erarbeitung komplexer Sachverhalte und über Sozialkompetenz zur konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums und mit dem Vorstand verfügen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat

die Unternehmenssituation und bewertet die Aufsichtsratsbesetzung in regelmäßigen Abständen.

Die Festlegung einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Mindestzahl von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern halten Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der Größe des Aufsichtsrats nicht für sinnvoll, um das künftige Auswahlermessen bei der Besetzung von Aufsichtsratspositionen nicht zu stark einzuschränken.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG wird keine feste Regelzugehörigkeitsdauer für die Aufsichtsratsmitglieder festlegen, da eine solche Festlegung den Handlungsspielraum sowie die Kompetenz des Aufsichtsrats negativ beeinträchtigen könnte. Das unabhängige und verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec nicht durch die Begrenzung der Verweildauer im Aufsichtsrat gefördert. Im Gegenteil, durch die komplexe Produkt- und Unternehmensstruktur ist eine gewisse Verweildauer im Aufsichtsrat eher positiv zu sehen, da im Zeitverlauf wertvolle unternehmensspezifische Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden, die zum Wohl des Unternehmens eingesetzt werden können.

SÜSS MicroTec prüft jeden potenziellen Kandidaten für den Aufsichtsrat hinsichtlich seiner Kompetenz und Verfügbarkeit, bevor ein Vorschlag an die Hauptversammlung gemacht wird. Zudem müssen potenzielle Kandidaten vorher eine Funktion als Vorstand, Geschäftsführer oder eine ähnlich verantwortungsvolle Position in einem vergleichbaren oder größeren Unternehmen, bevorzugt nahe unserer Branche, ausüben oder ausgeübt haben. Alternativ können Experten kandidieren, die ein besonderes Wissen und Erfahrungen für unser Unternehmen mitbringen, sofern dies als bedeutsam für den Unternehmenserfolg anzusehen ist. Es gibt jedoch keine feste Bestimmung eines ganz bestimmten Zeitaufwands, den Aufsichtsratsmitglieder aufzubringen haben. Grundsätzlich nimmt das Unternehmen Abstand von potenziellen Kandidaten, die bereits fünf oder mehr Mandate in Aufsichtsgremien bekleiden, und orientiert sich damit auch an Empfehlungen von Stimmrechtsberatern.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollen Frauen zukünftig mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen. Zudem sind börsennotierte und/oder mitbestimmungspflichtige Unternehmen seit 2015 gesetzlich verpflichtet, Zielgrößen für die Erhöhung des Frauenanteils unter anderem im Aufsichtsrat festzulegen und zu veröffentlichen sowie über deren Stand der Umsetzung zu berichten. Aufsichtsrat und Vorstand der SÜSS MicroTec AG haben im September 2015 festgelegt, dass die zu erreichende Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat bei null Prozent liegt. Zum Zeit-

punkt der Festlegung dieser Zielgrößen waren keine Frauen im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG tätig. Aus Sicht der SÜSS MicroTec AG ist die Qualifikation der Aufsichtsratskandidaten maßgebliches Kriterium für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats und damit für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei den Vorschlägen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unterstützt und berücksichtigt SÜSS MicroTec die im DCGK genannten Kriterien, sieht aber speziell in der Halbleiterbranche die Erfüllung einer bestimmten Quote für den Frauenanteil als problematisch an.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren.

Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativerklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen für Aufsichtsrat und Vorstand zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.

FESTLEGUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN FÜHRUNGSPPOSITIONEN

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec AG unter anderem verpflichtet worden, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus musste festgelegt werden, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von null Prozent. Damit wurde der Stand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung festgehalten, so dass sich die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG beschloss am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG ebenfalls eine Zielgröße von null Prozent. Damit wurde der Stand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung festgehalten, so dass sich auch insoweit die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Für die deutschen Gruppengesellschaften beschloss der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015, dass für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands jeweils eine Zielgröße von 20 Prozent für den Frauenanteil angestrebt wird, und legte eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 fest. Die Zielgröße für die erste Führungsebene bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 18 Prozent lag. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung, da der Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 14 Prozent lag. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus. Zum 31. Dezember 2016 erhöhte sich der Frauenanteil innerhalb der ersten Führungsebene auf 24 Prozent (Vorjahr 18 Prozent), der Frauenanteil in der zweiten Führungsebene erhöhte sich auf 15 Prozent (Vorjahr 14 Prozent).

ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie deren Mandate:

Dr. Per-Ove Hansson

- Dr. rer. nat. (Physik), Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender (bis 16. August 2016)

Weitere Mandate: keine

Dr. Franz Richter

- Dr.-Ing., Eichenau, Vorstandsvorsitzender (seit 7. September 2016)

Weitere Mandate:

- Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Meyer Burger Technology AG, Gwatt, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
- COMET Holding AG, Flamatt, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Scint-X AB, Stockholm, Schweden (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Michael Knopp

- Diplom-Kaufmann, Ratingen, Finanzvorstand

Weitere Mandate: keine

Walter Braun

- Diplom-Ingenieur, Altensteig, Produktionsvorstand

Weitere Mandate: keine

Dr. Stefan Reineck

- Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:

- AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of Directors)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- bis 25. Oktober 2016: Acceed 4.0 Beteiligungs-GmbH (vormals: Accel 4.0 Beteiligungs-GmbH), Heilbronn (Beiratsvorsitzender)
- bis 2. Juni 2016: AWS-Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)

Jan Teichert

- Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau, Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate: keine

Gerhard Pegam

- Au/Bad Feilnbach, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting, Au/Bad Feilnbach; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

VERÄNDERUNGEN IN VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mit Wirkung zum 16. August 2016 legte Dr. Per-Ove Hansson sein Amt als Vorstand und Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG nieder.

Mit Wirkung zum 7. September 2016 wurde Dr. Franz Richter in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender ist er verantwortlich für die einzelnen Produktlinien sowie die Bereiche Vertrieb und Marketing, Service, Forschung und Entwicklung, das Patentwesen und die Konzernstrategie.

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

Die im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2016 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

| | Anzahl der Aktien zum 31.12.2016 | Veränderung gegenüber 31.12.2015 | Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2016 | Veränderung gegenüber 31.12.2015 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Aufsichtsrat | | | | |
| Dr. Stefan Reineck | 9.600 | – | 0 | – |
| Jan Teichert | 0 | – | 0 | – |
| Gerhard Pegam | 0 | – | 0 | – |
| Vorstand | | | | |
| Dr. Franz Richter ¹⁾ | 60.000 | +60.000 | 0 | – |
| Dr. Per-Ove Hansson ²⁾ | 4.000 | +4.000 | 0 | – |
| Michael Knopp | 19.900 | +1.550 | 0 | – |
| Walter Braun | 18.300 | +15.150 | 0 | – |

¹⁾ Vorstandsvorsitzender seit 7. September 2016.

²⁾ Vorstandsvorsitzender bis 16. August 2016 (Anzahl Aktien per 16.08.2016).

MELDEPFLICHTIGE AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach Artikel 19 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Sämtliche Geschäfte des Vorstands und des Aufsichtsrats werden auf der Website des Unternehmens unter > www.suss.com > *Investor Relations* > *Die Aktie* > *Eigengeschäfte von Führungskräften* veröffentlicht.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 15. Juni 2016 bestellte die Hauptversammlung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2016. Damit

werden Jahresabschluss und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zum fünften Mal in Folge von einem Unternehmen der BDO-Gruppe geprüft. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 2016 neben der Prüfungstätigkeit keinerlei Beratungsleistungen für SÜSS MicroTec erbracht. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Leitender Prüfer für das Geschäftsjahr 2016 war Wirtschaftsprüfer Thomas Steiner, der die Abschlussprüfung und Konzernabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG zum dritten Mal als leitender Prüfer betreute.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 a HGB ist Bestandteil des Lageberichts und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter > www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Erklärung zur Unternehmensführung* allgemein zugänglich gemacht und ist zudem im zusammengefassten Lagebericht vollständig abgedruckt.

VERGÜTUNGSBERICHT

Die Grundzüge des Vergütungssystems haben wir im Vergütungsbericht dargestellt, der im zusammengefassten Lagebericht abgedruckt ist.

Zusammengefasster Lagebericht

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2016



| | |
|--|-----------|
| Wirtschaftsbericht | 54 |
| Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung | 54 |
| Wirtschaftliches Umfeld | 57 |
| SÜSS MicroTec in Zahlen | 58 |
| Die Holding – SÜSS MicroTec AG | 68 |
| Nachhaltigkeit | 70 |
| Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB | 74 |
| Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 a HGB | 76 |
| Vergütungsbericht | 80 |
| Vergütung des Vorstands | 80 |
| Vergütung des Aufsichtsrats | 85 |
| Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns | 86 |
| Prognosebericht | 97 |
| Branchenspezifische Rahmenbedingungen | 97 |
| Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten | 98 |
| Endogene Indikatoren | 99 |
| Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns – Ausblick 2017 | 100 |
| Zukunftsgerichtete Angaben | 101 |

Wirtschaftsbericht

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, UNTERNEHMENS- STEUERUNG UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleiterindustrie ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wobei die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2016 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden.

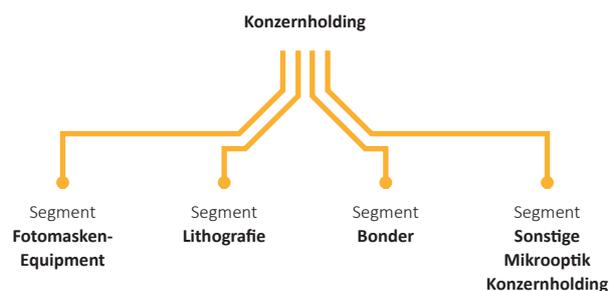
RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungs-holding, sowie den mehrheitlich im Eigentum der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

LEITUNG UND KONTROLLE – VERGÜTUNGSSTRUKTUR FÜR DIE ORGANMITGLIEDER

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Einzelnen Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

SEGMENTSTRUKTUR



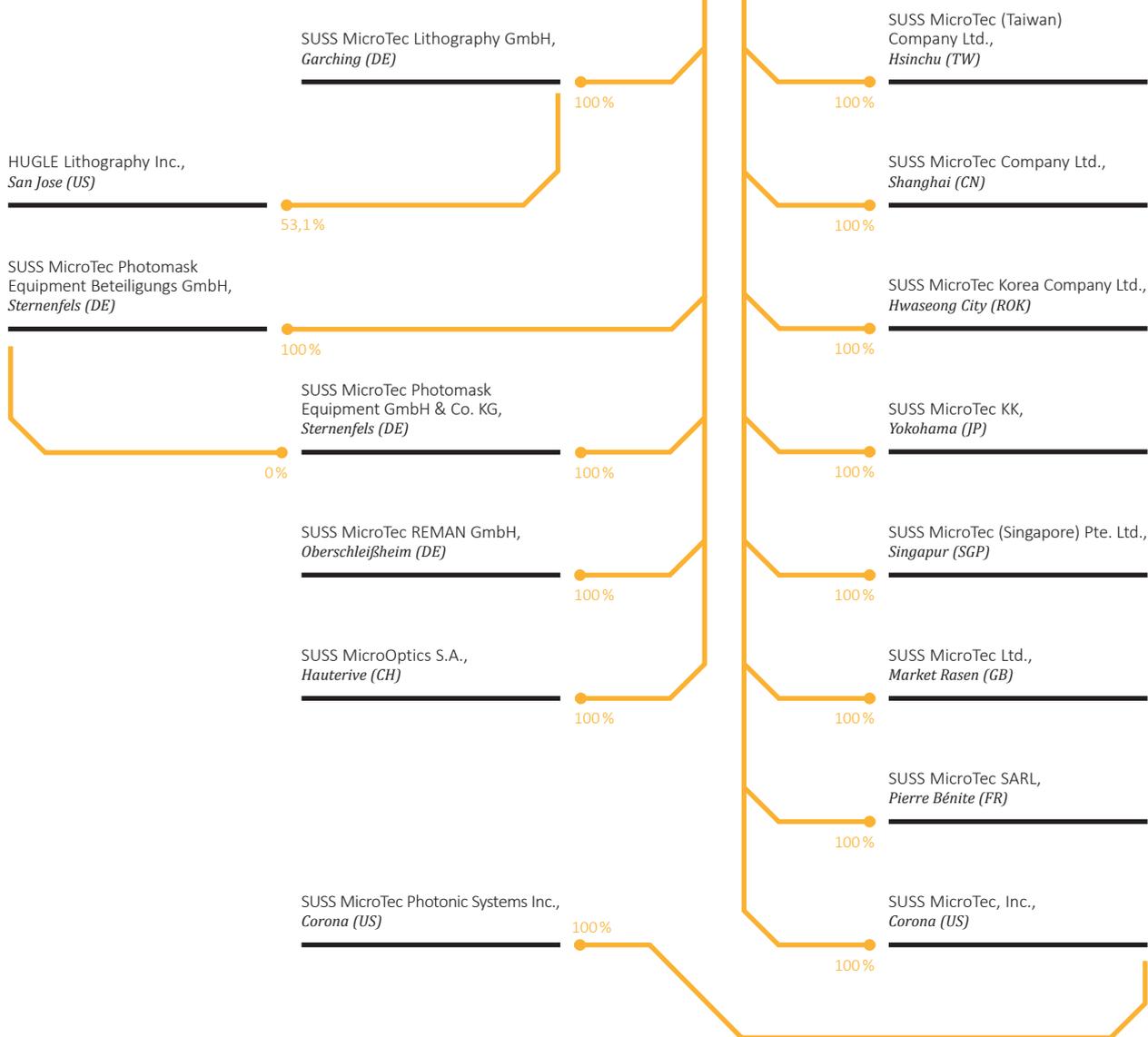
SÜSS MICROTEC AG

Garching (DE)

Sonstige / Nonoperating

Produktion

Vertrieb



Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an seiner Verantwortung und seinem Tätigkeitsumfang orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000 €, sein Stellvertreter 50.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

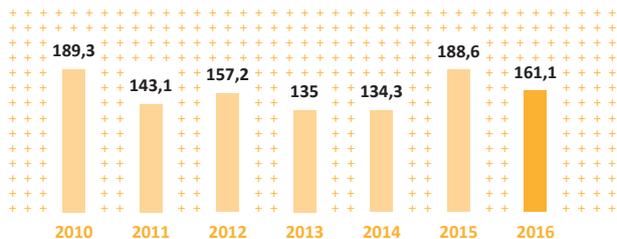
UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterrausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS

MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere am Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns. Eine weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt. In der folgenden Darstellung sehen Sie die Entwicklung wichtiger Kennzahlen seit 2010.

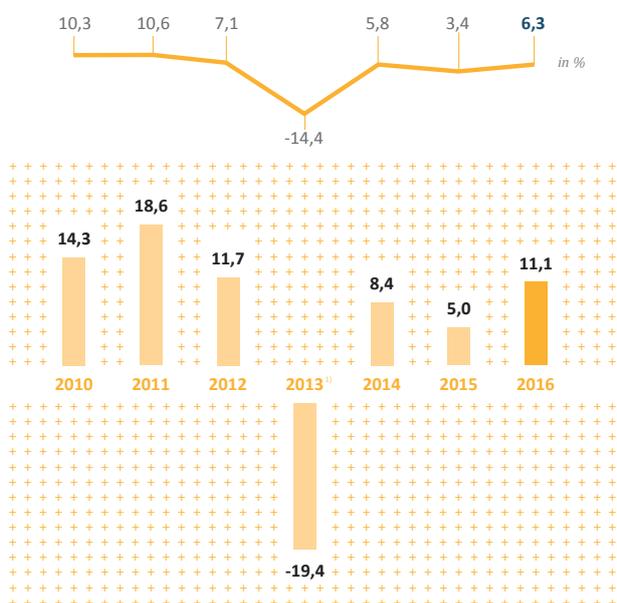
AUFTRAGSEINGANG in Mio. €



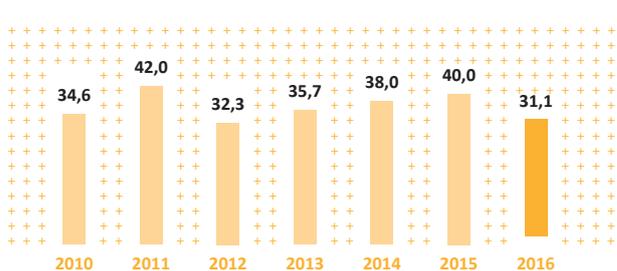
UMSATZ in Mio. € **UND BRUTTOMARGE** in %



EBIT in Mio. € **UND EBIT-MARGE**¹ in %



NETTOLIQUIDITÄT in Mio. €



¹ EBIT 2013 enthält Einmalkosten für die Refokussierung der Produktlinie permanente Bonder in Höhe von 13,2 Mio. €.

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

POLITISCHE UNSICHERHEIT PRÄGT DAS GESCHEHEN

Deutschland befindet sich seit 2013 in einem robusten Aufwärtstrend, welcher sich gemäß den Erwartungen der „ifo Konjunkturprognose 2016–2018“ vom 16.12.2016 weiter fortsetzen wird. Getrieben wird das Wachstum im Wesentlichen durch den privaten Konsum, weniger durch Investitionen in Anlagen oder Infrastruktur. Gleichzeitig gibt es hohe wirtschaftliche sowie politische Risiken, die das anhaltende Wachstum bremsen könnten. Die politische Landschaft hat sich im Jahr 2016 stark verändert: Großbritannien stimmte für einen Ausstieg aus der Europäischen Union, die Verfassungsreform in Italien scheiterte und nicht zuletzt betrat mit der US-Präsidentenwahl eine weitere unberechenbare Komponente die Bühne der Politik. Allein diese drei Umstände werden voraussichtlich weitreichende und ungewisse Konsequenzen für Deutschland und die gesamte Weltwirtschaft haben.

Im Geschäftsjahr 2016 legte die gesamtwirtschaftliche Produktion in der Welt um 2,4 Prozent zu. Die wirtschaftliche Dynamik ist in der Grundtendenz jedoch niedriger als in den Jahren vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Wirtschaftsleistung des Euroraums ist nach wie vor durch die strukturellen Schwächen einiger Mitgliedsstaaten belastet, entwickelte sich insgesamt jedoch positiv. Im Jahr 2016 wies der Euroraum ein Wachstum von 1,6 Prozent aus. Asien entwickelt sich weiterhin gut, doch die trendmäßige Abnahme des Expansionstempos, insbesondere in China, wird sich erwartungsgemäß in Zukunft fortsetzen. Lag das Wachstum in China 2014 noch bei 7,3 Prozent, so wird für 2017 eine Rate von 6,5 Prozent erwartet.

SPÜRBARE ERHOLUNG IM HALBLEITERMARKT

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2015 erholte sich der Halbleitermarkt im abgelaufenen Geschäftsjahr und wies ein Gesamtvolumen von 339,7 Mrd. USD nach 334,8 Mrd. USD im Vorjahr aus. Dies bedeutet ein Plus von rund 1,5 Prozent (Quelle: Gartner, Januar 2017). Nach einem schwachen Start in das Geschäftsjahr 2016 präsentierte sich das zweite Halbjahr in diesem Segment deutlich stärker. Die Nachfrage nach Halbleiterprodukten erhöhte sich insgesamt, Lagerbestände wurden aufgebaut und die Preise für einzelne Bauelemente, insbesondere für Speichermedien, stabilisierten sich. Der gesamte Halbleitermarkt wird von zehn großen Unternehmen dominiert, welche in Summe einen Marktanteil von 44 Prozent repräsentieren.

UMSATZENTWICKLUNG IM HALBLEITERMARKT *in Mrd. USD*



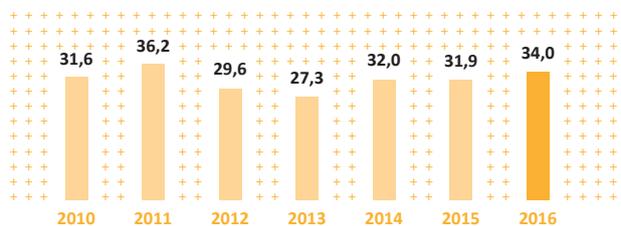
Quelle: Gartner 2010–2016

WACHSTUM IM SEGMENT HALBLEITEREQUIPMENT

Der Markt für Halbleiter-Equipment wuchs nach aktuellen Schätzungen des Branchenverbands SEMI im Jahr 2016 um rund 8,7 Prozent. Für 2017 geht der Branchenverband SEMI in seinen Schätzungen vom 14. Dezember 2016 von einem erneuten Zuwachs im Halbleiter-Equipment-Bereich von 39,69 Mrd. USD im Jahr 2016 auf 43,40 Mrd. USD im Jahr 2017 aus, dies entspricht einem deutlichen Plus von 9,3 Prozent. Neben Taiwan konnte auch China im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich zulegen und entwickelte sich somit zu einem bedeutenden Abnehmer der Branche. Die Region Europa sowie Korea konnten ihre Position gegenüber 2015 behaupten, lediglich Nordamerika verzeichnete rückläufige Umsätze im Halbleiter-Equipment-Bereich.

Der für SÜSS MicroTec relevante Spezialbereich Wafer-Level-Packaging and -Assembly konnte im Geschäftsjahr 2016 um 3,9 Prozent gegenüber Vorjahr zulegen. Ein Grund hierfür ist die Nachfrage nach Smartphones, welche sich zuletzt besser als ursprünglich erwartet entwickelt hatte. Dies wirkte sich insbesondere für Speichermedien wie NAND sowie den Bereich MEMS positiv aus. SÜSS MicroTec konnte, nicht zuletzt durch den hohen Auftragsbestand zum Jahresende 2015, im Geschäftsjahr 2016 hohe Umsätze im Bereich Wafer-Level-Packaging ausweisen. Gemäß der Erwartung von Branchenexperten wird sich dieses Marktsegment auch in den kommenden Jahren weiterhin sehr dynamisch entwickeln.

UMSATZENTWICKLUNG BEI WAFER-FAB-EQUIPMENT *in Mrd. USD*



Quelle: Gartner 2010–2016

SÜSS MICROTEC IN ZAHLEN

ERTRAGSLAGE: AUFTRAGSEINGANG, UMSATZ UND EBIT

Vergleich Gesamtjahreszahlen 2016 – Prognose 2016

Im Prognosebericht des Lageberichts 2015 stellte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 170 Mio. € bis 180 Mio. € sowie ein Ergebnis (EBIT) in der Bandbreite von 9 Mio. € bis 13 Mio. € in Aussicht. Die Umsatz- und Ergebnisprognose wurde während des Geschäftsjahres 2016 nicht angepasst. SÜSS MicroTec schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz in Höhe von 177,6 Mio. € ab. Das EBIT erreichte einen Wert von 11,1 Mio. €. Damit lag das Unternehmen im Umsatz und Ergebnis im Rahmen der eigenen Erwartung.

| in Mio. € | Prognose 2016 | Ergebnis 2016 |
|------------|---------------|---------------|
| Umsatz | 170–180 | 177,6 |
| EBIT | 9–13 | 11,1 |
| EBIT-Marge | – | 6,3% |

Unternehmensentwicklung im Jahr 2016

Der Auftragseingang belief sich im Geschäftsjahr 2016 auf insgesamt 161,1 Mio. €, während im Vorjahr ein Auftragseingang von 188,6 Mio. € erzielt wurde. Insbesondere das vierte Quartal 2016, in dem ein Auftragseingang von 59,5 Mio. € verbucht wurde, hatte großen Einfluss auf das Jahresergebnis. Damit lagen die Auftrags-eingänge 2016 rund 14,6 Prozent unter den Auftrags-eingängen des Vorjahres. Zum 31. Dezember 2016 ergab sich ein Auftrags-bestand von 101,5 Mio. €, der damit um rund 16,1 Mio. € unter dem Auftragsbestand des Vorjahres (117,6 Mio. €) lag. Das Ver-hältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsät-zen (Book-to-Bill-Ratio) lag bei 0,91 nach 1,27 im Vorjahr.

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2016 einen deutlichen Umsatzanstieg und ein positives Jahres-ergebnis. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vor-jahr um rund 19,6 Prozent und beliefen sich auf 177,6 Mio. €, während im Vorjahr Umsätze von 148,5 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich 2016 auf 11,1 Mio. €. 2015 wurde ein EBIT von 5,0 Mio. € erreicht.

Im umsatzstärksten Segment von SÜSS MicroTec, der Lithografie, wurde ein Umsatzplus von 27,5 Mio. € erzielt. Der Anteil der Umsätze des Segments Lithografie betrug 2016 rund 75 Prozent der gesamten Konzernumsätze. Im Segment Bonder war ein leichter Umsatzanstieg um rund 2,6 Mio. € zu verzeichnen. Im Segment Fotomaschinen-Equipment ergaben sich Umsatzrückgänge von 3,8 Mio. €, während im Segment Sonstiges ein Umsatzanstieg von 2,8 Mio. € verbucht werden konnte.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwick-lungskosten in Höhe von 0,1 Mio. € enthalten. Neuaktivierungen wurden in 2016 nicht vorgenommen. Die Abschreibungen auf Entwicklungskosten betreffen ausschließlich das Segment Litho-

grafie. Im Vorjahr wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwick-lungskosten von 0,1 Mio. € erfasst. Die Neuaktivierungen sum-mierten sich im Vorjahr auf 1 Tsd. €.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Rohertrag von 58,6 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 33,0 Prozent entspricht. Im Vor-jahr betrug der Rohertrag 49,4 Mio. €; die Rohertragsmarge 2015 belief sich auf 33,3 Prozent.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres haben sich erhöht und lagen bei 20,5 Mio. € (Vorjahr: 18,8 Mio. €), was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 11,6 Prozent (Vorjahr: 12,7 Prozent) entspricht. In den Vertriebskosten ist die Hälfte einer Abfindung für ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied enthalten, die sich auf insgesamt 0,75 Mio. € beläuft.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten sind im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich angestiegen und beliefen sich auf 14,1 Mio. € (Vorjahr: 12,8 Mio. €). SÜSS MicroTec hat – wie geplant – seine Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung weiter ausgebaut. In den Forschungs- und Entwicklungskosten ist die Hälfte einer Abfindung für ein ausgeschiedenes Vorstandsmit-glied enthalten, die sich auf insgesamt 0,75 Mio. € beläuft.

Die Verwaltungskosten erhöhten sich leicht von 13,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 13,6 Mio. € und entsprechen damit einer Auf-wandsquote von 7,7 Prozent (Vorjahr: 8,9 Prozent).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 4,3 Mio. € (Vorjahr: 4,9 Mio. €). Sie beinhalten – wie auch im Vorjahr – hohe Fremdwährungsgewinne, die sich aus der Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro ergeben haben. Daneben konnten Provisionserträge von rund 0,9 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) erzielt werden. Im Vorjahr wurden durch eine Stornovereinbarung mit einem Kunden Erträge von 0,6 Mio. € vereinnahmt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2016 auf 3,5 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen sowie Auf-wendungen für sonstige Steuern.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich im abge-lauten Geschäftsjahr auf 11,1 Mio. €. Im Jahr 2015 wurde ein EBIT von 5,0 Mio. € erzielt.

Das Finanzergebnis belief sich 2016 auf -0,6 Mio. € (nach -0,3 Mio. € im Vorjahr). Hierin enthalten sind Finanzaufwendungen von 0,4 Mio. €, die aus der Glattstellung eines Zinsswaps resultieren.

Das Konzernergebnis vor Steuern von 10,5 Mio. € ist mit einem Steueraufwand von 5,5 Mio. € belegt, was einer durchschnittli-chen Steueraufwandsquote von rund 52,4 Prozent entspricht. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand sind vor allem im Geschäftsjahr 2016 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzern-

planung (analog zu den Vorjahren) keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Dadurch wird für die in den ausländischen Gesellschaften entstandenen Verluste kein entsprechender Steuerertrag berücksichtigt.

Im Vorjahr war das Konzernergebnis vor Steuern von 4,7 Mio. € mit einem Steueraufwand von 4,5 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 95 Prozent entsprach. Somit wich auch im Vorjahr die tatsächliche Steueraufwandsquote deutlich von der erwarteten Steueraufwandsquote ab. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand waren ebenfalls im Geschäftsjahr 2015 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern von 5,0 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,26 € nach 0,01 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 Prozent von 213 Tsd. € auf 250 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

ENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask-Aligner, UV-Projektions-scanner, Laser-Processing-Tools sowie Belacker und Entwickler. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von mehr als 70 Prozent der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 105,0 Mio. € (Vorjahr: 149,6 Mio. €) sowie einen Umsatz von 133,8 Mio. € (Vorjahr: 106,3 Mio. €). Dies entspricht einem Rückgang im Auftragseingang von 29,8 Prozent sowie einem Plus im Umsatz von 25,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der deutliche Anstieg im Umsatz wurde über alle Produktlinien erzielt. Mit unseren neuartigen UV-Projektions-scannern war es uns 2015 erstmals gelungen, einen Großauftrag für die Serienfertigung bei einem wichtigen Halbleiterhersteller zu gewinnen. Diese Scanner für Anwendungen im Bereich Fan-out-WLP konnten wir im Geschäftsjahr 2016 in den Umsatz bringen.

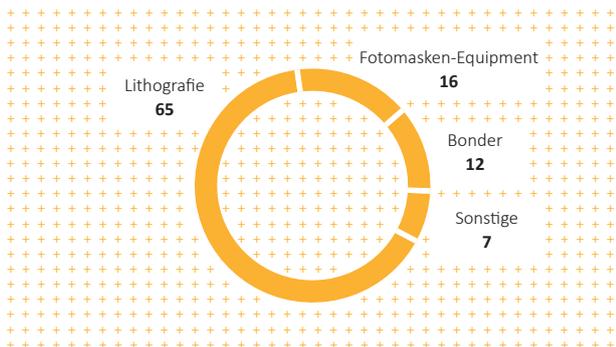
Der Rohertrag im Segment Lithografie lag im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich unter dem Vorjahreswert. Die Rohertragsmarge lag 2016 bei 31,5 Prozent nach 34,2 Prozent im Vorjahr. Die Verringerung der Rohertragsmarge ist auf die negative Marge für UV-Projektions-scanner zurückzuführen, welche das Ergebnis des Segments Lithografie im Geschäftsjahr 2016 erheblich belastete.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 13,2 Mio. € (Vorjahr: 9,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 9,8 Prozent, die sich im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert hat (Umsatzrendite des Vorjahres: 9,1 Prozent). Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte bei den Belackern und Entwicklern trotz der schwierigen Wettbewerbssituation eine deutliche Verbesserung der Margen erreicht werden. Dem stehen rückläufige Margen in der Produktlinie Mask-Aligner gegenüber.

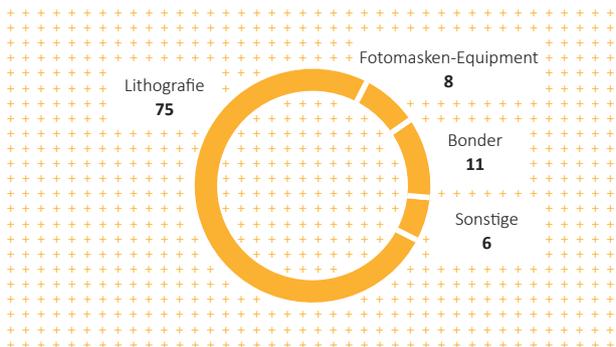
KENNZAHLEN LITHOGRAFIE

| <i>in Mio. €</i> | 2016 | 2015 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Auftragseingang | 105,0 | 149,6 |
| Segmentumsatz | 133,8 | 106,3 |
| Segmentergebnis EBIT | 13,2 | 9,7 |
| Nettovermögen | 59,3 | 51,3 |

AUFTRAGSEINGANG NACH SEGMENTEN *in %*



UMSATZ NACH SEGMENTEN *in %*



Bonder

Das Segment Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 18,6 Mio. € (Vorjahr: 10,5 Mio. €) als auch im Umsatz mit 14,0 Mio. € (Vorjahr: 11,4 Mio. €) sehr positiv. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden gegenüber 2015 insbesondere in der Produktlinie permanentes Bonden deutlich mehr Aufträge erzielt. Positiv wirkte sich hier die Markteinführung der XB8 im dritten Quartal 2015 aus. Nach zunächst zögerlichem Markteintritt bestellten die Kunden in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine größere Anzahl von Maschinen des Typs XB8. Zudem konnten in der Produktlinie temporäres Bonden neue Aufträge und Kunden gewonnen werden. Für die Zukunft erwarten wir in diesem Bereich weiterhin steigende Auftragseingänge und Umsätze, insbesondere durch die Einführung neuer Produkte wie beispielsweise des neuen automatischen Bonders XBS200 sowie durch den Ausbau von Marktanteilen bei der MEMS- und LED-Herstellung.

Das Rohergebnis des Segments Bonder war im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut positiv. Die Rohertragsmarge verbesserte sich deutlich von 19,3 Prozent auf 36,3 Prozent. Die Margen im Bereich Temporary Bonding und Debonding sowie das verbleibende Geschäft mit permanenten Bond-Systemen verbesserten sich nachhaltig. Im Segment Bonder ergibt sich ein Segmentergebnis (EBIT) von -1,7 Mio. € nach -4,0 Mio. € im Vorjahr.

KENNZAHLEN BONDER

| in Mio. € | 2016 | 2015 |
|----------------------|------|------|
| Auftragseingang | 18,6 | 10,5 |
| Segmentumsatz | 14,0 | 11,4 |
| Segmentergebnis EBIT | -1,7 | -4,0 |
| Nettovermögen | 5,1 | 5,7 |

Fotomasken-Equipment

Das Segment Fotomasken-Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind, und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken-Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec überwiegend im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken-Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang erneut besser als im Vorjahr. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2016 bei 26,3 Mio. € (Vorjahr: 21,5 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 19,7 Mio. € nach 23,5 Mio. € im Jahr 2015. Die Geräte zur Reinigung von Fotomasken sind sehr komplex und hochwertig, SÜSS MicroTec hält in diesem Bereich einen Marktanteil von rund 80 Prozent. Der Gesamtmarkt insgesamt ist vergleichsweise klein und so werden pro Jahr nur ca. drei bis fünf Maschinen gefertigt und verkauft. Verschiebt sich der Verkauf einer Maschine über einen Berichtsstichtag hinaus, so kann es von Quartal zu Quartal, aber auch von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr zu nicht unerheblichen Schwankungen im Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis kommen.

Die Rohertragsmarge erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 leicht auf 32,7 Prozent. Im Geschäftsjahr 2015 konnte ein Wert von 31,5 Prozent erreicht werden.

Das Segment Fotomasken-Equipment trug mit einem Segmentergebnis von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 9,2 Prozent und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2015: 9,9 Prozent) leicht verringert.

KENNZAHLEN FOTOMASKEN-EQUIPMENT

| in Mio. € | 2016 | 2015 |
|----------------------|------|------|
| Auftragseingang | 26,3 | 21,5 |
| Segmentumsatz | 19,7 | 23,5 |
| Segmentergebnis EBIT | 1,8 | 2,3 |
| Nettovermögen | 14,8 | 6,8 |

Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen.

Der Auftragseingang steigerte sich nochmals erheblich von 7,0 Mio. € im Geschäftsjahr 2015 auf 11,2 Mio. € im Jahr 2016. Der Segmentumsatz belief sich auf 10,1 Mio. € nach 7,3 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Größten Anteil am Umsatz und Auftragseingang hatte dabei – wie auch im Vorjahr – das Geschäftsfeld Mikrooptik, das einen erhöhten Auftragseingang von 10,9 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €) sowie im Umsatz einen Anstieg von 6,8 Mio. € auf 9,9 Mio. € erzielte.

KENNZAHLEN SONSTIGE

| in Mio. € | 2016 | 2015 |
|----------------------|------|------|
| Auftragseingang | 11,2 | 7,0 |
| Segmentumsatz | 10,1 | 7,3 |
| Segmentergebnis EBIT | -2,1 | -3,1 |
| Nettovermögen | 20,9 | 19,9 |

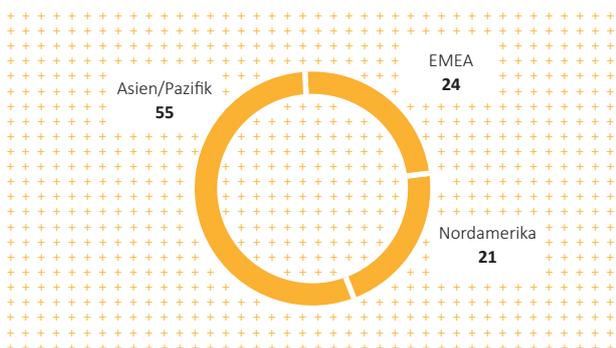
ENTWICKLUNG IN DEN WICHTIGSTEN REGIONEN

EMEA (Europe, Middle East, Africa), Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir ab dem Geschäftsjahr 2016 die Region Asien nicht mehr in „Japan“ und „Sonstiges Asien“, sondern weisen nunmehr alle Auftragseingänge und Umsätze aggregiert unter der Region Asien aus. Die Umsätze in Japan waren zuletzt sehr gering und unterlagen zudem einer hohen Volatilität, so dass eine einzelne Darstellung dem Leser keinen Mehrwert bot.

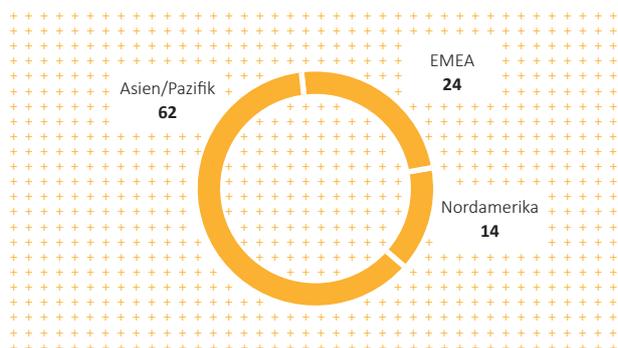
Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2016 war insgesamt geringer als 2015, da insbesondere im vierten Quartal 2015 sehr hohe Auftragseingänge zu verzeichnen waren. In der Region Nordamerika konnte im vergangenen Geschäftsjahr dennoch ein Zuwachs im Auftragseingang erwirtschaftet werden. Dieser erhöhte sich von 27,6 Mio. € auf 33,7 Mio. €, dies entspricht einem Plus von 22,1 Prozent. Die Regionen EMEA und Asien hingegen wiesen geringere Auftragseingänge als noch im Geschäftsjahr 2015 aus. In der Region EMEA sank der Auftragseingang um 21,9 Prozent auf 38,1 Mio. €. In Asien fiel der Auftragseingang um 20,4 Prozent auf 89,3 Mio. €. Asien bleibt mit einem Auftragseingang von unternehmensweit mehr als 50 Prozent weiterhin die wichtigste Absatzregion für SÜSS MicroTec.

Betrachtet man den Umsatz, so ergibt sich abgesehen von Nordamerika ein sehr positives Bild. Nordamerika verzeichnete einen Umsatzrückgang um 9,2 Prozent auf 25,4 Mio. €. Hierzu hat insbesondere der Rückgang im Umsatz mit Belackern und Entwicklern geführt. Die Regionen EMEA und Asien konnten gegenüber Vorjahr deutlich um 6,4 Prozent auf 43,1 Mio. € beziehungsweise um 36,3 Prozent auf 109,0 Mio. € zulegen. In der Region EMEA konnten gegenüber Vorjahr mehr Belacker und Entwickler in den Umsatz gebracht werden. Die umsatzstärkste Region Asien konnte in fast allen Bereichen zulegen. Besonders gut entwickelt haben sich die Produktlinien Belacker und Entwickler sowie die Bonder. Hier konnten nennenswerte Umsätze mit chinesischen Kunden generiert werden. In der Region Asien wurden zudem die neuartigen UV-Projektionsscanner erstmals in erheblichem Volumen in den Umsatz gebracht.

AUFTRAGSEINGANG NACH REGIONEN in %



UMSATZ NACH REGIONEN in %



FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Eine stabile Finanz- und Vermögenslage zeichnet SÜSS MicroTec aus

Die Net-Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln und Finanzverbindlichkeiten – verringerte sich von 40,0 Mio. € im Vorjahr auf 31,1 Mio. € zum 31. Dezember 2016. Der Bestand an liquiden Mitteln reduzierte sich von 49,1 Mio. € im Vorjahr auf 35,6 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf -5,5 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €). Grund für den stark negativen operativen Cashflow waren zum einen deutliche Anstiege der Kundenforderungen und des Vorratsbestands, die mit rund 10,7 Mio. € bzw. 6,1 Mio. € Liquiditätsmindernd wirkten. Zum anderen weist der SÜSS MicroTec Konzern zum Jahresende stichtagsbedingt deutlich geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus als noch im Vorjahr; daraus zeigen sich im operativen Cashflow Liquiditätsabflüsse von rund 5,5 Mio. €. Im Gegenzug war ein Anstieg der erhaltenen Anzahlungen zu verzeichnen, die den operativen Cashflow mit rund 4,4 Mio. € positiv beeinflussten.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere -3,6 Mio. € (Vorjahr: -3,4 Mio. €). Die Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise Maschinen, die die SÜSS MicroOptics, Hauterive, Schweiz, für die Ausweitung ihrer Produktion angeschafft hat; hierfür waren Mittelabflüsse von rund 0,9 Mio. € zu verzeichnen. In den Gebäuden an den Produktionsstandorten Garching und Sternenfels wurden Erneuerungen und Einbauten in Höhe von rund 0,5 Mio. € vorgenommen. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen und in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften sowie der SÜSS MicroTec Photonics Inc., Corona, USA, getätigt. Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrafen vorwiegend Neuanschaffungen von EDV-Software.

Der freie Cashflow belief sich damit auf -9,1 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verkäufen) von 1,3 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -4,6 Mio. € (Vorjahr: -1,2 Mio. €) und resultiert zum einen aus den geleisteten, planmäßigen Tilgungen in Höhe von insgesamt 1,0 Mio. € für das Bankdarlehen der SÜSS MicroTec AG, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Garching dient. Zum anderen wirkt hier die vorzeitige, komplette Tilgung des Bankdarlehens der SÜSS MicroTec AG, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels diene. Dieses Darlehen wies zum 31. Dezember 2015 noch einen Darlehensstand von 3,6 Mio. € auf und wurde im Juni 2016 komplett zurückgeführt.

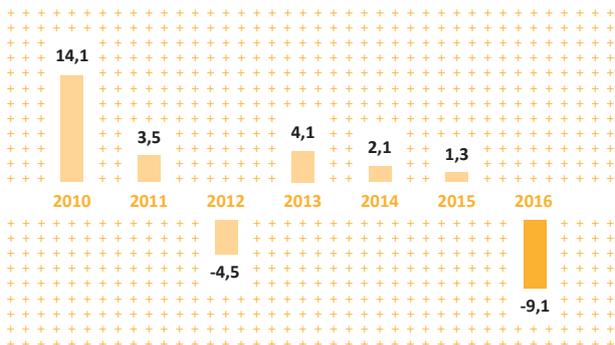
Neben liquiden Mitteln in Höhe von 35,6 Mio. € (Vorjahr: 49,1 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 5,25 Mio. € (Vorjahr: 9,0 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 2,8 Mio. €.

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank AG und unter Beteiligung der DZ Bank AG und der Baden-Württembergischen Bank stellt Kredit- und Avallinien in Höhe von 4,5 Mio. €. Diese Linien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Die Linien können von der SÜSS MicroTec AG oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden.

Zwischen der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der Baden-Württembergischen Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Avallinie in Höhe von 0,75 Mio. € gestellt wird. Die Avallinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.

Im Vorjahr stand dem Konzern eine weitere Avallinie in Höhe von 2,5 Mio. € zur Verfügung, die von einer Versicherungsgesellschaft auf Basis eines Kautionsversicherungsvertrags bereitgestellt wurde. Der Kautionsversicherungsvertrag wurde im November 2016 beendet, da diese Avallinie nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurde und voraussichtlich bis auf weiteres nicht benötigt wird.

FREIER CASHFLOW in Mio. €



NETTOLIQUIDITÄT in Mio. €



Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,8 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist dem Segment Lithografie zugeordnet.

Die aktivierten Entwicklungskosten weisen zum 31. Dezember 2016 einen Buchwert von 0,2 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €) auf, der komplett dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Sie spielen für die Vermögenslage des Konzerns nur noch eine untergeordnete Rolle.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie das bei der SÜSS MicroTec AG aktivierte SAP-System, deren Buchwerte sich auf 2,4 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €) summieren. Sie entfallen in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Bonder und Fotomaschinen-Equipment sowie in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic-Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) aufwies und dem Segment Lithografie zugeordnet ist. Die Technologie dotiert in US-Dollar und wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,9 Mio. € (Vorjahr: 13,8 Mio. €) aufwiesen. Dort sind die SUSS MicroTec Lithography GmbH, die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS MicroTec AG ansässig.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist.

Der Buchwert des Sachanlagevermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 2,2 Mio. € nach 2,5 Mio. € im Vorjahr. Sie reduzierten sich im Wesentlichen durch die Veränderung der aktiven latenten Steuern auf Unterschiede in der Vorratsbewertung und der immateriellen Vermögenswerte sowie durch die Nutzung von aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge. Die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SÜSS MicroTec AG als Organträger und den Organgesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec REMAN GmbH) hat 2016 ein deutlich positives steuerliches Ergebnis erzielt und nutzt damit die in Vorjahren entstandenen Verlustvorträge. Zum 31. Dezember 2016 bestehen für die deutschen Gesellschaften keine steuerlichen Verlustvorträge mehr. Für die Tochtergesellschaften in Frankreich und in Korea wurden – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung für 2017 – aktive latente Steuern auf Verlustvorträge in geringem Umfang angesetzt. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften wurden hingegen keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 3,0 Mio. € auf 136,8 Mio. € angestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf den stark gestiegenen Bestand an Vorratsvermögen sowie auf hohe Kundenforderungen zum Jahresende zurückzuführen. Der Bestand an liquiden Mitteln ist hingegen – unter Berücksichtigung des hohen negativen Cashflows – deutlich zurückgegangen.

Die Vorräte erhöhten sich von 68,7 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 73,8 Mio. € zum Jahresende. Die Erhöhung ist zum Teil auf den um rund 3,8 Mio. € angewachsenen Bestand an fertigen Maschinen zurückzuführen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen jedoch die Endabnahme (und damit die Umsatzlegung) noch aussteht. Außerdem hat sich der Bruttobestand an Demonstrationsgeräten um 4,4 Mio. € und der Bestand an Materialien und Hilfsstoffen um 0,6 Mio. € erhöht. Beim Bestand an unfertigen Erzeugnissen war hingegen ein Rückgang um rund 2,1 Mio. € zu verzeichnen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 13,1 Mio. € auf 24,1 Mio. €. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der Bestand an liquiden Mitteln sank von 49,1 Mio. € auf 35,6 Mio. €.

Der Anstieg der sonstigen Vermögenswerte von 2,3 Mio. € im Vorjahr auf 2,8 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf höhere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

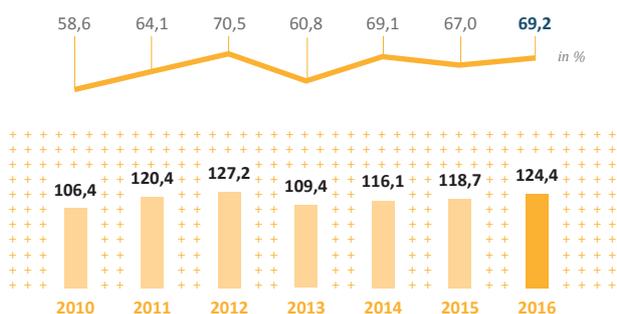
Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 13,1 Mio. € auf 8,3 Mio. €. Unter den langfristigen Schulden werden zum einen die Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen, die sich im Geschäftsjahr auf 3,5 Mio. € (Vorjahr: 7,9 Mio. €) beliefen. Zum anderen sind hier die Pensionsverpflichtungen des SÜSS MicroTec Konzerns enthalten, für die zum Jahresende ein Betrag von 4,8 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €) passiviert war. Der deutliche Rückgang der Finanzverbindlichkeiten resultiert zum einen aus der planmäßigen Tilgung des Darlehens für die Grundstücksfinanzierung Garching,

die sich insgesamt auf 1,0 Mio. € belief. Zum anderen wurde das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels, das zum 31. Dezember 2015 noch einen Darlehensstand von 3,6 Mio. € aufwies (davon waren 3,4 Mio. € als langfristige Finanzverbindlichkeiten klassifiziert), im Juni 2016 komplett zurückgeführt.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein Anstieg von 45,4 Mio. € im Vorjahr auf 46,9 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Die hier enthaltenen Kundenanzahlungen sind deutlich angestiegen und beliefen sich zum Geschäftsjahresende auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 18,2 Mio. €). Bei den Rückstellungen war ebenfalls ein deutlicher Anstieg von 2,4 Mio. € im Vorjahr auf 5,2 Mio. € zum 31. Dezember 2016 zu verzeichnen, der aus höheren Garantierückstellungen sowie Rückstellungen für die Neuausrichtung des Vertriebs in Japan und für die Abfindung eines Vorstandsmitglieds resultierte. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind hingegen stichtagsbedingt auf 3,4 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €) gesunken.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2015 um 5,7 Mio. € auf 124,4 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im Jahresvergleich von 67,0 Prozent auf 69,2 Prozent.

EIGENKAPITAL in Mio. € **UND EIGENKAPITALQUOTE** in %



INVESTITIONEN

Gezielte Investitionen stärken das Unternehmen

Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin der Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, an denen der Firmensitz sowie die Betriebe der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben. Die SÜSS MicroTec AG investiert laufend in die Betriebsgebäude an den beiden Standorten, um die Lagerräume sowie die Produktions- und Verwaltungsräume auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 Prozent des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

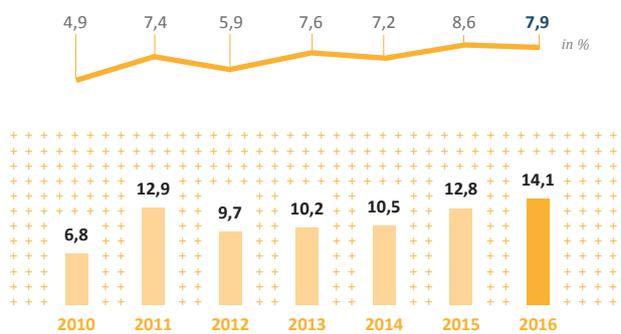
Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin des konzernweiten SAP-Systems, das sowohl von den deutschen Gesellschaften als auch von den US-Gesellschaften SÜSS MicroTec, Inc., Corona, USA, und SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, sowie von der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu, Taiwan, genutzt wird.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöhten sich von 12,8 Mio. € im Vorjahr auf 14,1 Mio. €, was im Geschäftsjahr 2016 in Relation zum Umsatz einer Aufwandsquote von 8,0 Prozent (Vorjahr: 8,6 Prozent) entspricht. Sie betrafen mit 8,7 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €) das Segment Lithografie und mit 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) das Segment Bonder. 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) waren dem Segment Fotomaschinen-Equipment zuzuordnen.

Ende 2016 waren 153 Mitarbeiter – und damit fast jeder fünfte Mitarbeiter von SÜSS MicroTec – im Bereich Forschung und Entwicklung tätig (Vorjahr: 147 Mitarbeiter).

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-AUFWAND (F&E) in Mio. € UND F&E-QUOTE in % vom Umsatz



Lithografie

Das größte Segment vereinigt die Produktlinien Mask-Aligner, UV-Projektionsgeräte, Laser-Processing sowie Belacker und Entwickler.

Belacker und Entwickler – Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten innerhalb der Produktgruppe Belacker und Entwickler lag im Geschäftsjahr 2016 eindeutig auf der ACS300 Gen3. Die neue Plattform ist speziell auf den Advanced-Packaging-Markt zugeschnitten. An oberster Stelle stand das Ziel, für unsere Kunden eine Anlage mit noch attraktiveren Betriebskosten zu entwickeln. Die Nassprozess- und Temperaturmodule können erstmalig nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander platziert werden. Dies führt zu einem völlig neuen und hochkompakten Maschinenkonzept. So kommt die ACS300 Gen3 ohne jeglichen seitlichen Freiraum aus und die Anlagen können im Produktionsbetrieb nahtlos aneinandergereiht werden. Dies spart wertvollen Platz im Reinraum unserer Kunden.

Die modulare Bauweise der Anlage ermöglicht eine effiziente Fertigung. So können viele Arbeiten während der Produktion einer Anlage parallel ausgeführt werden. Trotz der individuellen Anpassung der Einzelmaschinen an Kundenwünsche und einer freien Anordnung der verschiedenen Prozessmodule ist durch SÜSS MicroTec ebenfalls ein hoher Grad an Vorfertigung möglich. Das neue Konzept kann die Durchlaufzeit eines Maschinenauftrags somit erheblich reduzieren. Die immer kürzer werdenden Beschaffungszeiten, die der Markt fordert, werden so optimal adressiert. Die Markteinführung der neuen Plattform erfolgte während der SEMICON Taiwan im September 2016.

Sowohl die 200-mm- als auch die 300-mm-Produktlinie der automatisierten Belacker- und Entwickleranlagen profitieren von der sukzessiven Weiterentwicklung der Steuerungssoftware. Es wurde beispielsweise eine flexible Möglichkeit geschaffen, die Anlage zwischen zwei unterschiedlichen Handhabungsarten umzuschalten. Die Anlagen können entweder durchsatzoptimiert betrieben werden oder modulabhängig auf die Anforderungen von besonders stark verbogenen Substraten reagieren. Auch auf geänderte Bedingungen innerhalb der Anlage reagiert die Software nun dynamisch. Bei inaktiven Modulen, beispielsweise aufgrund von Wartungsarbeiten, werden die Abläufe innerhalb der Maschine kontinuierlich so optimiert, dass bei höchstmöglicher Prozesssicherheit der optimale Durchsatz erreicht wird.

Mask-Aligner – Die Produktlinie Mask-Aligner hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die vierte Generation der MA/BA-Plattform auf den Markt gebracht. Diese halbautomatische Mask- und Bond-Aligner-Familie (für Wafer von Bruchstückgrößen bis zu 8 Zoll Durchmesser) zeichnet sich durch eine einfache Handhabung, eine moderne, übersichtliche Benutzerführung und einen besonders kleinen Platzbedarf im Reinraum (Footprint) aus. Als kostengünstiges Grundgerät bietet die MA/BA-Gen4-Serie eine hervorragende Auflösung kleinster Strukturen und beste Justagegenauigkeit. Damit ist sie ideal sowohl für Universitäten und Institute als auch für die industrielle Entwicklung und Kleinserienfertigung, die das Gerät nach eigenen Bedürfnissen mit einer Vielzahl von Optionen ausstatten können.

Als erster Hersteller auf dem Markt bietet SÜSS MicroTec seit April 2016 einen halbautomatischen Mask-Aligner mit umweltfreundlichem UV-LED-Lampenhaus an. Die zukunftsfähigen UV-LEDs bieten eine höchst energieeffiziente und wartungsfreie Lichtquelle mit einer extrem langen Lebensdauer. Die LEDs müssen nur während der tatsächlichen Belichtung eingeschaltet werden. Damit entfällt der immense Energieverbrauch der durchgängig brennenden bisher genutzten Quecksilberdampflampen. Auch zeitintensive Aufwärmphasen, die durchgängige Flow-Kühlung, besondere Gesundheits- und Arbeitsschutzvorkehrungen und nicht zuletzt die aufwändige Entsorgung sind nicht mehr notwendig.

Darüber hinaus wurden in der Produktlinie Mask-Aligner weitere spannende Forschungs- und Entwicklungsprojekte vorangetrieben. So wurde beispielsweise für mehrere Kunden eine neue Generation von Wafer-Level-Optik-Prozessen und -Technologien für manuelle und halbautomatische Mask-Aligner entwickelt, die speziell auf die steigenden Kundenanforderungen im Hinblick auf die Integration von optischen Bauelementen in die Halbleiterfertigung zielt. Zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen im Kundenmaterial und damit zur Verringerung der Ausschussquote wurde im Geschäftsjahr 2016 darüber hinaus eine sogenannte ESD („Electrostatic Discharge“)-Handling-Lösung für die automatischen Mask-Aligner entwickelt. Die von SÜSS MicroTec angebotenen ESD-Lösungen sind für Neumaschinen und als Upgrade für bestehende Maschinen verfügbar. Sie werden mit dem weltweiten Trend zu kleineren und empfindlicheren Strukturen zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen.

Insgesamt ist es im Bereich Mask-Aligner gelungen, den großen Auftragsbestand zum Jahresbeginn 2016 termingerecht abzuwickeln. Dazu gehört beispielsweise die Auslieferung mehrerer MA200 Gen3, die im Vergleich zum Vorgängermodell viele neue Features aufweisen können. Gerade die großen Produktionskunden sind mit Funktionen wie dem AGS („Active Gap Setting“) und der kurzen Ramp-up-Zeit für Neumaschinen sowie der ausgezeichneten Dauerbetriebsleistung der Produktionsmaschinen sehr zufrieden.

UV-Projektionsscanner – Diese Produktlinie wird am Standort Corona, USA, gefertigt. Wie bereits im Geschäftsbericht 2015 dargestellt, war es SÜSS MicroTec gelungen, einen großen Produktionskunden für die neuartige DSC300 zu gewinnen. Diese Scanner wurden im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 an den Kunden ausgeliefert und in Betrieb genommen. Die Weiterentwicklung dieses Produkts stand auch 2016 im Fokus der Ingenieure in Corona. Es wurde beispielsweise das thermische Management des Geräts optimiert, um auch bei kontinuierlicher Volumenproduktion gleichbleibend gute Prozessergebnisse zu erreichen. Die DSC300 wurde durch Verbesserung des Overlays, beispielsweise durch gezieltes Aufheizen der Maske, weiter für Fan-out Wafer-Level-Packaging-Prozesse optimiert. Abschließend sei hier noch die Entwicklung von Partikelschutzbarrieren erwähnt, die die Qualität der Belichtungsergebnisse sicherstellen werden.

Bonder

Dieses Segment untergliedert sich in die beiden Produktlinien temporäres und permanentes Bonden.

Ein großer Fokus lag auf der Entwicklung einer neuen automatisierten Plattform für permanente Bondverfahren bei MEMS-, RF- und LED-Anwendungen. Die neue XBS200 kann Wafergrößen bis 200 mm bearbeiten und verfügt über eine neuartige Transportvorrichtung zur Übergabe justierter Wafer vom Bond-Aligner in die Bondkammer. Das Bond-Aligner-Modul der XBS200 erreicht extrem hohe Justagegenauigkeiten und lässt sich automatisiert kalibrieren. Die Bondkammern der XBS200 basieren auf dem XB8-Bonder und bieten eine Bondkraft von bis zu 100 kN bei bis zu 550 °C Bondtemperatur. Die neue Plattform wurde im ersten Quartal 2017 in den Markt eingeführt.

Beim temporären Bonden wurden kontinuierliche Verbesserungen an den Produktionsplattformen XBS300 und XBC300 Gen2 vorgenommen. Dies geschah in Zusammenarbeit mit verschiedenen asiatischen und einem europäischen Produktionskunden sowie mit Kooperationspartnern aus dem Forschungsumfeld. Die LF300-Bondkammer wurde mit einer höheren Bondkraft von jetzt 15 kN anstelle von 8 kN ausgestattet, um zusätzliche kleberbasierte permanente und temporäre Bondverfahren abdecken zu können. In Zusammenarbeit mit einem externen Partner wurde ein Modul zum Abziehen von Kleberrückständen von dünnen Wafern nach dem Debonden mittels Klebefolie entwickelt („Detaper“). Das neue Modul kann in die bestehende XBC300-Gen2-Plattform eingebunden werden und ermöglicht das Entfernen von Kleberrückständen mit kostengünstigen Mitteln. Das neue Verfahren stellt damit eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Umwelteigenschaften der Kleberreinigung nach dem Debonden dar.

Im Applikationsbereich wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt und qualifiziert, das eine Kombination von Excimer-Laser-Debonden und anschließendem Entfernen der Kleberrückstände vom Wafer mittels Klebefolie erlaubt.

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2016 die langjährige und erfolgreiche Entwicklungspartnerschaft mit dem Forschungsinstitut imec in Belgien sowie die direkten Kooperationen mit Materialherstellern fortgeführt.

Fotomasken-Reinigung

Nach mehrfachen Verzögerungen in den vergangenen Jahren hat die EUVL („Extreme Ultraviolet Lithography“)-Technologie im Frontend der Halbleiterfertigung deutlich an Fahrt aufgenommen und eine produktive Einführung ist inzwischen für den 7/5-nm-HP („Half Pitch“)-Technologieknoten geplant. Dennoch sind bis dahin noch ein paar wesentliche Hürden zu nehmen, wie zum Beispiel die Bereitstellung einer umfassenden und funktionierenden Maskeninfrastruktur. Ein kritischer Faktor ist der Einsatz eines EUVL-Pellicle (Schutzschicht), welches, wie bei der heute meistverbreiteten 193i-Lithografie, die aktive Seite der Fotomaske vor Partikeln und Defekten schützt und so späteren Abbildungsfehlern auf dem Wafer vorbeugt. Aufgrund der intrinsischen Eigenschaften dieses EUVL-kompatiblen Pellicle, müssen bei der wiederkehrenden Rückseitenreinigung von EUV-Masken, bei der das Pellicle möglichst auf der Vorderseite der Maske verbleibt, entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit das Pellicle während des Handlings oder der Reinigung unversehrt bleibt.

Im Rahmen des europäischen Verbundprojekts SeNaTe („Seven Nanometer Technology“), stellt SÜSS MicroTec für seine Maskenreinigungsanlage MaskTrack PRO hierfür entsprechende Technologien bereit. Im Jahr 2016 lag hierbei der Fokus auf dem Design einer speziellen Halterung, die es ermöglicht, dass das Pellicle während des Rückseitenreinigungsprozesses auf der Fotomaske verbleibt, aber dennoch weder beschädigt noch kontaminiert wird. Der Prototyp dieser Halterung stand zum Ende des Geschäftsjahres 2016 zur Verfügung und wird ab dem ersten Quartal 2017 bei einem Kunden evaluiert.

Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der Evaluierung einer schwefelsäurefreien Methode zur Abreinigung von Kleberesten, die bei der Demontage von Pellicles auf der Vorderseite der Fotomaske verbleiben. Im Anschluss an die Festlegung einer geeigneten Chemikalie wurde entsprechend eine spezielle Reinigungsstation entwickelt, welche es erlaubt, diese Chemikalie ausschließlich lokal auf die betroffenen Stellen der Fotomaske aufzubringen, wodurch insgesamt die Unversehrtheit bzw. eine Verlängerung des Lebenszyklus der Fotomaske erreicht wird. Diese Reinigungsstation wurde zum Ende des Jahres an einen Kunden ausgeliefert, bei dem sie ab 2017 getestet wird.

Beide zuvor genannten Technologien sind Teil der neuen Technologieplattform MaskTrack X, welche auf dem Design und der Infrastruktur der etablierten MaskTrack-PRO-Anlage basiert, die aber für die Anforderungen der kommenden 7-nm- und 5-nm-Technologieknoten zahlreiche neue Reinigungs- und Oberflächenbehandlungstechnologien bereitstellt.

Auch eine auf Software-Algorithmen basierende sogenannte „Smart Cleaning“-Technologie wurde erfolgreich in den Markt eingeführt. Die „Impact Distribution Control“ erlaubt die spezielle Synchronisation von Abläufen in der Reinigungskammer, wodurch die Gleichförmigkeit und die Effizienz der Fotomasken-Reinigung verbessert werden, was wiederum zur Steigerung der Nutzungsdauer einer Fotomaske beiträgt.

Im Bereich der Bake/Develop-Prozesstechnologie wurde die neue Generation der 25-Zonen-kontrollierten Hotplate eingeführt. Diese Hotplate adressiert die extremen Anforderungen an die Wiederholgenauigkeit der CD („Critical Dimensions“)-Signatur bei der Herstellung von 193i-Fotomasken für die Multi-Patterning-Technologie. Neben der Verbesserung der Temperaturwiederholgenauigkeit wurde zudem eine weitere Verbesserung der Temperaturgleichmäßigkeit erzielt.

DIE HOLDING – SÜSS MICROTEC AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor-Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDING

| in Tsd. € | SMT AG (HGB) | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------|------|
| | 2016 | 2015 | Änderung | in % |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -9.500 | -8.491 | -1.009 | – |
| Eigenkapital | 78.148 | 87.648 | -9.500 | -11 |
| Bilanzsumme | 124.834 | 137.668 | -12.834 | -9 |
| EK-Quote in % | 63 | 64 | | |
| Anlagevermögen | 67.574 | 81.885 | -14.311 | -17 |
| % der Bilanzsumme | 54 | 59 | | |
| Umlaufvermögen inkl. ARAP | 57.260 | 55.784 | 1.476 | 3 |
| % der Bilanzsumme | 46 | 41 | | |

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände belaufen sich zum Stichtag auf 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zum Bilanzstichtag mit 47,5 Mio. € (Vorjahr: 51,7 Mio. €) bilanziert.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden bei der SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA, Kapitalerhöhungen in Höhe von 3,1 Mio. € durchgeführt. Gegenläufig wirkt sich eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Wertansatz dieser Beteiligung von rund 6,8 Mio. € aus. Des Weiteren wurde der Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec Ltd., Vereinigtes Königreich, um rund 0,6 Mio. € sowie der Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec KK, Japan, um rund 0,1 Mio. € abgewertet.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sanken um rund 9,9 Mio. € auf einen Buchwert von 4,4 Mio. €. An die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, wurden im Geschäftsjahr weitere Darlehensbeträge von 6 Mio. USD (5,5 Mio. €) ausgereicht. Gleichzeitig erklärte die SÜSS MicroTec AG im Zuge einer Kapitalrestrukturierung auf bereits in Vorjahren voll wertberichtigte Darlehensforderungen einen Darlehensverzicht in Höhe von 15 Mio. USD (11,5 Mio. €). Zum 31. Dezember 2016 belief sich das Darlehen auf nominal 29,5 Mio. USD (Vorjahr: 38,5 Mio. USD). Da für die SUSS MicroTec Photonic Systems auf Basis der aktuellen Konzernplanung ein negatives Ergebnis erwartet wird, zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung dieses Gesellschafterdarlehens um weitere 13,1 Mio. € an. Das Darlehen wurde entsprechend um diesen Betrag außerplanmäßig abgeschrieben und weist zum 31. Dezember 2016 einen Buchwert von 2,8 Mio. € auf.

Auch das an die SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährte Darlehen von 775 Mio. JPY (Vorjahr: 775 Mio. JPY) wurde aufgrund verhaltener Ertragsaussichten der Gesellschaft, die sich im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Vertriebs in Japan ergaben, abgewertet. Der im Geschäftsjahr 2016 erfasste Abwertungsbetrag beläuft sich auf 2,3 Mio. €; das Darlehen weist zum 31.12.2016 einen Buchwert von 1,6 Mio. € auf.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen um 18,6 Mio. € auf 33,5 Mio. € an. Der Anstieg ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. In diesem Betrag sind die Forderungen aus den Ergebnisabführungen der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec REMAN GmbH sowie der phasengleichen Gewinnvereinnahmung der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG enthalten.

Im Geschäftsjahr sank die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec AG um 17,2 Mio. € auf 22,6 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stiegen im Geschäftsjahr um 0,4 Mio. € auf 36,7 Mio. € an.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2016 um 4,6 Mio. €. Der Rückgang resultiert zum einen aus den geleisteten, planmäßigen Tilgungen in Höhe von 1,0 Mio. € für ein Bankdarlehen, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient. Zum anderen wirkt hier die vorzeitige, komplette Tilgung des Bankdarlehens, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels diente. Dieses Darlehen wies zum 31. Dezember 2015 noch einen Darlehensstand von 3,6 Mio. € aus und wurde im Juni 2016 komplett zurückgeführt.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses reduzierte sich das Eigenkapital der Gesellschaft von 87,6 Mio. € auf 78,1 Mio. €.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2016 ein Jahresfehlbetrag von 9,5 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 8,5 Mio. €).

Die Umsatzerlöse der Holding beliefen sich auf 9,3 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €) und umfassten im Wesentlichen die den Tochtergesellschaften in Rechnung gestellten Umlagen für Managementleistungen, Marketing und Versicherungen. Darüber hinaus waren in den Umsatzerlösen auch Weiterbelastungen für das konzernweite SAP-System und Lizenzgebühren enthalten. Es ergibt sich eine inhaltliche Änderung infolge der neuen Umsatzdefinition in § 277 Abs. 1 HGB. Demnach sind zusätzlich zu der Weiterberechnung der bei der SÜSS MicroTec AG entstandenen Aufwendungen auch Mieterlöse in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) enthalten, die im Vorjahr unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ erfasst wurden.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €).

Aufgrund des seit 1. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrags mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 11,7 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €) ertragswirksam erfasst. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) erfasst. Weiterhin wurden aus der phasengleichen Ergebnisvereinnahmung der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG Beteiligungserträge von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) gebucht. Darüber hinaus hat die Holding aus Dividendenausschüttungen der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan, und der SUSS MicroTec Ltd., Market Rasen, Vereinigtes Königreich, Beteiligungserträge von insgesamt rund 2,1 Mio. € erzielt.

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens umfassen die Zinserträge für die langfristigen Darlehen, die an die Tochtergesellschaften SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, und SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährt wurden.

Auf die Finanzanlagen wurden Abwertungen in Höhe von 22,8 Mio. € (Vorjahr: 16,9 Mio. €) vorgenommen. Davon entfielen 6,8 Mio. € auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA, 0,6 Mio. € auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec Ltd., Market Rasen, Vereinigtes Königreich, sowie 0,1 Mio. € auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan. 13,1 Mio. € bzw. 2,3 Mio. € betrafen Abwertungen auf langfristige Darlehen, die der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, bzw. der SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan, gewährt wurden.

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,2 Mio. €, was im Wesentlichen auf die vorzeitige, vollständige Tilgung des Bankdarlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2016 durchschnittlich 19 (Vorjahr: 18) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich im Wesentlichen aus der Veränderung der Wechselkurse von USD und JPY ergeben. Der Geschäftsverlauf, die Lage sowie die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken der SÜSS MicroTec AG als Holding unterscheiden sich nicht grundsätzlich vom Konzern. Der Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG wird jedoch von Bewertungseffekten im Bereich des Finanzanlagevermögens beeinflusst.

NACHHALTIGKEIT

Seit mehr als sechzig Jahren ist SÜSS MicroTec in der Fertigung von Anlagen und der Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturierungen tätig. In unserem schnelllebigen und von kurzen Innovationszyklen geprägten Geschäftsumfeld ist es notwendig, stets neue Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Dennoch schließen sich ökologisches und ökonomisches Denken nicht aus. Nachhaltiges Wirtschaften ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, welcher bei uns eine sehr hohe Priorität genießt. Als Technologieführer und Innovationstreiber fühlen wir uns nicht nur der Erstklassigkeit unserer Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern – wir streben nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander.

Darüber hinaus legen wir die gleichen hohen Maßstäbe an Zulieferer und Geschäftspartner an. Wir sind einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung verpflichtet und möchten den Leserinnen und Lesern auf den kommenden Seiten einen Überblick über unsere Aktivitäten im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung geben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter > www.suss.com > *Unternehmen* > *Qualitätsmanagement* > *Nachhaltigkeit*.

COMPLIANCE

Jeder Angestellte trägt eine Mitverantwortung für das Erscheinungsbild unseres Unternehmens und dafür, dass unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen wird. Unser Selbstverständnis umfasst zudem die Integration aller Mitarbeiter, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder Religion. Im Verhaltenskodex sind die Verhaltensregeln für SÜSS MicroTec-Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern sowie der Umgang unter den Mitarbeitern geregelt. Er soll helfen, die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter zu stärken. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Verhaltensregeln des Verhaltenskodex und die Compliance-Regeln zu befolgen. Seit dem Geschäftsjahr 2014 haben wir ein webbasiertes Hinweissystem (Whistleblowing) auf mögliche Compliance-Verstöße installiert. Die Meldungen gehen per E-Mail anonymisiert oder unter freiwilliger Angabe des Namens direkt an die Rechtsabteilung.

Im Geschäftsjahr 2015 haben wir den Verhaltenskodex sowie unser Compliance-Handbuch komplett überarbeitet. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir, wie im Geschäftsbericht 2015 angekündigt, unseren Fokus auf das Thema Compliance weiter verstärkt. Es wurden weltweit Compliance-Schulungen für Führungskräfte abgehalten, welche ihrerseits Schulungen mit ihren Mitarbeitern durchgeführt haben. Zunächst lag der Schwerpunkt der Schulungen bei Mitarbeitern, die direkten Kontakt zu Kunden, Lieferanten oder anderen dritten Parteien haben. Im Geschäftsjahr 2016 wurde darüber hinaus an einem Online-Schulungssystem gearbeitet, welches

zukünftig eine Compliance-Schulung sowie ein Abschlusstestsystem für sämtliche Mitarbeiter des Konzerns beinhalten wird. Die Einführung dieses Systems ist für das Geschäftsjahr 2017 geplant.

QUALITÄTSMANAGEMENT

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomaschinen-Equipment, Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen. Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagementsystem, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz nach ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

UMWELTVERANTWORTUNG

ISO-14001-Zertifizierung

Seit 1996 bildet die Norm ISO 14001 die Grundlage für Aufbau, Einführung, Überwachung und Weiterentwicklung von Umweltmanagementsystemen. Sie legt entsprechende Forderungen fest, die auf Organisationen jeder Art und Größe sowie auf unterschiedliche geografische, kulturelle und soziale Bedingungen anwendbar sind. Das übergeordnete Ziel ist, den Umweltschutz zu fördern und Umweltbelastungen zu verringern – im Einklang mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernissen. Die ISO 14001 ist gleichzeitig auch die Grundlage für die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen.

Bei SÜSS MicroTec beschäftigen wir uns im Rahmen des Umweltmanagements bereits seit 2014 intensiv mit der Vorbereitung auf die ISO-14001:2015-Zertifizierung. In den Geschäftsjahren 2015 und 2016 wurden die Vorbereitungen zur Systemanalyse sowie die Dokumentation zur Vorabprüfung erstellt. Im Geschäftsjahr 2016 fand dann die eigentliche ISO-Zertifizierung statt, welche erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Durch diese Zertifizierung können wir nun auch auf internationaler Ebene ein anerkanntes Umweltmanagementsystem vorweisen. Dazu gehören zahlreiche Anforderungen an den Bereich Umweltmanagement, unter anderem zu umweltrelevanten Produkteigenschaften, Umweltkennzahlen oder der Umweltleistungsbewertung.

SÜSS MicroTec gehört damit zu einem der ersten Unternehmen, welche die Herausforderung der neuen ISO-Norm angenommen haben. Mit der Erlangung der ISO-14001:2015-Zertifizierung – als Ergänzung zur ISO 9001 – ergänzte das Unternehmen sein umfassendes Managementsystem. Beide Zertifizierungen sind Ausdruck unseres umfassenden Engagements in Sachen Umwelt und Qualität. Für SÜSS MicroTec war es zudem wichtig, sein weitreichendes Bewusstsein auch formal mit den ISO-Zertifizierungen zu dokumentieren.

Die Auditoren waren mehrere Tage an den beiden deutschen Unternehmensstandorten Garching sowie Sternenfels und hinterfragten und prüften die praktische Arbeit und auch die Ergebnisse im Unternehmen. Sie kamen schlussendlich zu dem Ergebnis, dass die Erteilung der Zertifikate empfohlen wurde. Durch die Angleichung der umweltpolitischen Zielsetzungen an die gewohnt hohen Maßstäbe bezüglich Qualität, Service und Effizienz steht SÜSS MicroTec zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung und beweist einmal mehr, dass sich Umweltschutz und Rentabilität nicht ausschließen.

Generalüberholung unserer Maschinen

Mit großer Sorgfalt konstruieren unsere Mitarbeiter unsere Maschinen, die häufig für eine lange Nutzungszeit ausgelegt sind. Eine Lebensdauer von bis zu 15 Jahren oder länger ist keine Seltenheit und liefert einen Beweis für die herausragende Wirtschaftlichkeit. Jahr für Jahr zeigen die Anlagen von SÜSS MicroTec ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit. Mit unserem Tochterunternehmen SÜSS MicroTec REMAN bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, gebrauchte, von uns sorgfältig generalüberholte Maschinen zu einem günstigeren Preis zu erwerben. Damit entlasten wir das Beschaffungsbudget unserer Kunden, verlängern die Lebensdauer gebrauchter Maschinen und sparen wertvolle Ressourcen. Die SÜSS MicroTec REMAN steuert schon seit vielen Jahren einen Beitrag zum Unternehmenserfolg bei.

Umgang mit Chemikalien

Der sorgfältige Umgang mit Chemikalien spielt insbesondere bei unseren Belackern und Entwicklern eine große Rolle. Die fortlaufende Verbesserung unserer Maschinen im Hinblick auf den Verbrauch von Nasschemikalien ist ein wichtiges Ziel unserer Entwicklungsarbeit im Unternehmen. Ein gewisser Einsatz an Nasschemie ist jedoch für die Prozessabläufe in der Halbleiterfertigung bisher zwingend notwendig.

Im Garchinger Applikationslabor, in dem Testläufe an unseren Maschinen stattfinden, wurde deshalb eine Neutralisationsanlage zur Abwasserbehandlung installiert, welche den pH-Wert der verschiedenen Chemikalien auf ein verträgliches Niveau anpasst.

Entwicklung von umweltschonenden Maschinen und Prozessen

Als Spezialmaschinenbauer im Halbleitersegment sind wir mit Produkten am Markt, die maßgeblich dazu beitragen, energieeffiziente Endprodukte herzustellen und CO₂-Emissionen zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist die Herstellung von energiesparenden Leuchtdioden (LED). Mit dem MA100/150e Gen2 bieten wir eine Mask-Aligner-Plattform speziell für die Verarbeitung empfindlicher Verbindungshalbleiter, wie z. B. sehr heller LEDs (UBH).

Zudem wurde im Geschäftsjahr 2016 ein neuartiges UV-LED-Lampenhaus für den Einsatz in den Belichtungsgeräten (Mask-Alignern) von SÜSS MicroTec entwickelt und in den Markt eingeführt. Mit der Entwicklung und Umsetzung des umweltfreundlichen UV-LED-Lampenhauskonzepts für Mask-Aligner ist uns ein weiterer wichtiger Schritt im Hinblick auf Ressourcenschonung und Umweltschutz gelungen. Die Lebensdauer der innovativen UV-LED-Lichtquelle ist um ein Vielfaches höher als bei der bisher verwendeten Quecksilberdampfampe. Zusätzlich entfallen im Produktionsprozess die zeit- und energieintensiven Aufwärm- und Abkühlphasen – die LED muss nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Belichtung tatsächlich durchgeführt wird. Beide Faktoren tragen wesentlich zum geringeren Energieverbrauch bei. Zudem stellt die LED-Technologie hinsichtlich des Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutzes eine deutlich verbesserte Lösung dar. Schlussendlich ermöglicht der Einsatz von LED Beleuchtung in der Lithografie eine deutlich flexiblere Prozessgestaltung und ist damit eine ideale Ergänzung zu SÜSS Mask Aligner MO Exposure Optics, was optimale Belichtungsergebnisse sicherstellt.

Darüber hinaus kommen viele Bauelemente (etwa Hochleistungsschaltkreise), die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt werden, in der Industrie für erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie zum Einsatz. Aber auch die Verbesserungen der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte selbst sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. So legen wir verstärkt Wert auf einen möglichst geringen Einsatz von Chemikalien und gefährlichen Prozessmaterialien im Fertigungsprozess und während des Betriebs unserer Maschinen. Bei Belackungs- und Entwicklungsgeräten sowie Fotomasken-Equipment lässt sich durch innovatives Prozessmanagement und ein ausgeklügeltes Maschinendesign der Verbrauch der verwendeten Medien reduzieren. Dies spart unseren Kunden bares Geld und entlastet die Umwelt.

Rückläufiger Strom- und Gasverbrauch

Grundsätzlich hängt der Strom- und Gasverbrauch in unserer Produktion davon ab, wie viele Maschinen pro Jahr gebaut werden. Bei einer hohen Kapazitätsauslastung werden die Strom- und Heizölkosten erwartungsgemäß höher liegen als bei einer geringen Auslastung. Dennoch können nicht nur unsere Maschinen und Prozesslösungen ihren Beitrag zur Ressourcenschonung leisten, sondern auch die Mitarbeiter in der Fertigung und im Büro. Jeder Mitarbeiter ist angehalten, mit Strom, Wasser sowie Papier und anderen Ressourcen sorgsam umzugehen. So ist es uns im Geschäftsjahr 2016 gelungen, trotz sehr hoher Kapazitätsauslastung an beiden deutschen Standorten den Strom- und Gasverbrauch gegenüber Vorjahr zu senken. Seit einigen Jahren ist insgesamt ein erfreulicher Rückgang im Strom- sowie im Heizölverbrauch zu verzeichnen.

MITARBEITER

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ermöglichen unseren Mitarbeitern, sich einzubringen und sich entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen weiterzuentwickeln. Denn die Motivation, das Wissen und die Flexibilität unserer Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen Unternehmenserfolg.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2016 waren 711 (Vorjahr: 698) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt. Im gesamten Unternehmen waren zum 31. Dezember 2016 30 Auszubildende in kaufmännischen und technischen Bereichen beschäftigt (2015: 26). Seit jeher arbeitet das Unternehmen eng mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen, um den Namen SÜSS MicroTec möglichst früh an talentierte Absolventen heranzutragen und den Nachwuchs für das erfolgreiche Bestehen des Unternehmens zu sichern.

Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders

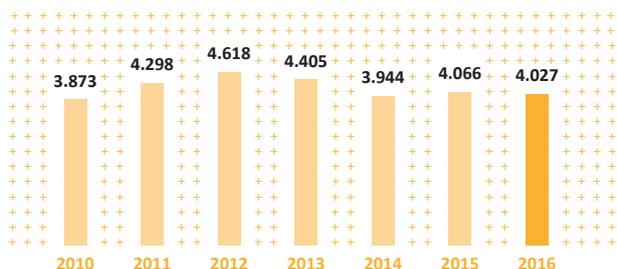
am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt (www.suss.com > Unternehmen > Qualitätsmanagement > Umweltverantwortung), gibt es spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese regelmäßig aus.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde erstmalig ein kostenpflichtiger, mobiler Massageservice am Standort Garching getestet, welcher auf sehr positive Resonanz im Unternehmen gestoßen ist. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wird dieser Service nun regelmäßig alle zwei Wochen für unsere Mitarbeiter angeboten und so gut angenommen, dass derzeit darüber nachgedacht wird, das Angebot auf einen wöchentlichen Rhythmus zu erhöhen.

An den Standorten Garching und Sternenfels wurden im Geschäftsjahr 2016 verschiedene Maßnahmen im Hinblick auf die Mitarbeitergesundheit durchgeführt. In Sternenfels fand ein Gesundheitstag statt, bei dem die Mitarbeiter einen sogenannten Back-Check machen konnten. Hierbei wurde unter anderem die Haltekraft der Bauch- und Rückenmuskeln gemessen. In einem anschließenden Beratungsgespräch wurden Tipps und Informationen zum richtigen Training der Rückenmuskulatur gegeben. Darüber hinaus konnte an diesem Tag eine Muskeltonusmessung vorgenommen werden. Auch am Standort Garching fand ein Gesundheitstag statt. Hier konnten Mitarbeiter ihre Blutwerte, den Sauerstoffgehalt im Blut und vieles andere mehr professionell bestimmen und auswerten lassen. Es gab zudem eine Anleitung zur Muskelentspannung nach Jacobson sowie zur visuellen Stressbewältigung. Die Maßnahmen wurden von den Kollegen gut angenommen und die Termine waren gut besucht.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist. Insgesamt geben wir dem Thema Compliance seit dem Geschäftsjahr 2016 einen noch größeren Stellenwert. Das Compliance-

STROMVERBRAUCH STERNENFELS UND GARCHING in MWh



HEIZÖLVERBRAUCH STERNENFELS UND GARCHING in Hektoliter



Handbuch sowie der Verhaltenskodex wurden im angelaufenen Geschäftsjahr überarbeitet und die neuen Versionen an die Mitarbeiter weltweit versandt. Zudem haben Compliance-Schulungen für die Führungskräfte im Unternehmen stattgefunden.

Die Führungskräfte wurden ihrerseits angehalten, Schulungen mit ihren Mitarbeitern durchzuführen. Die Teilnahme an den Schulungsveranstaltungen wird zentral dokumentiert und nachgehalten. Der Fokus lag zunächst auf Mitarbeitern, welche einen direkten Kontakt zu Kunden, Lieferanten oder anderen dritten Parteien haben. Für das Geschäftsjahr 2017 ist die Einführung einer verpflichtenden Compliance-Schulung (Online-Schulung) für alle Mitarbeiter geplant. Damit tut SÜSS MicroTec alles in seiner Macht Stehende, um die Mitarbeiter für das Thema Compliance und den Verhaltenskodex zu sensibilisieren und vor einem möglichen Fehlverhalten zu schützen.

Durch das im Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind bestimmte Gesellschaften verpflichtet, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat sowie Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus muss festgelegt werden, bis wann der jeweilige Frauenanteil erreicht werden soll.

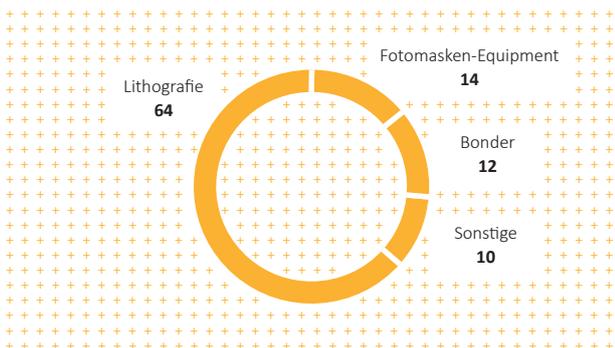
Für die deutschen Gruppengesellschaften beschloss der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015, dass für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands jeweils eine Zielgröße von 20 Prozent für den Frauenanteil angestrebt wird, und legte eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 fest. Die Zielgröße für die erste Führungsebene bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 18 Prozent lag. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung, da der Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 14 Prozent lag. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus. Zum 31. Dezember 2016 erhöhte sich der Frauenanteil innerhalb der ersten Führungsebene auf 24 Prozent (Vorjahr: 18 Prozent), der Frauenanteil der zweiten Führungsebene erhöhte sich auf 15 Prozent (Vorjahr: 14 Prozent).

KUNDENBEZIEHUNGEN

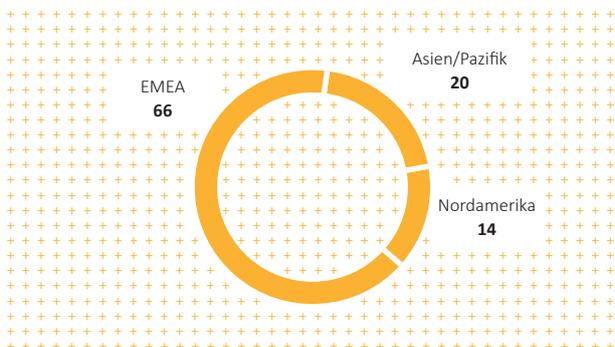
Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang mit insiderrlevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated-Device-Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

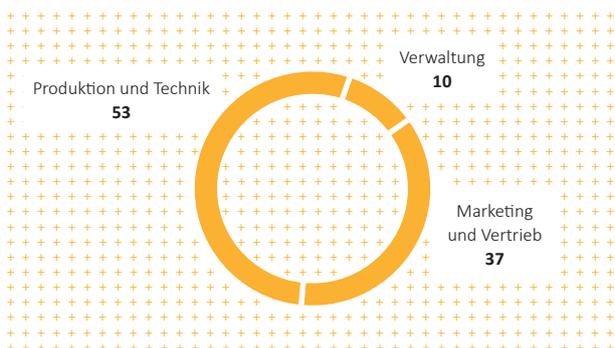
MITARBEITER NACH SEGMENTEN 2016 in %



MITARBEITER NACH REGIONEN 2016 in %



MITARBEITER NACH BEREICHEN 2016 in %



Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

1.

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Zum 31. Dezember 2016 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2.

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3.

Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4.

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5.

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

6.

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7.

Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital 2013) zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 Prozent des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach § 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebots erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8.

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bindung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots anstehen

Mit den Banken des Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse/ein Change of Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9.

Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind

Entschädigungsvereinbarungen o. Ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum 8. März 2017 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter suss.com > *investor relations* > *corporate governance* allgemein zugänglich gemacht.

RELEVANTE ANGABEN ZUR UNTERNEHMENS- FÜHRUNG NACH § 289A HGB

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB ist Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. Gemäß § 317 Abs. 2 Satz 4 HGB sind die Angaben nach § 289a Abs. 2 HGB nicht in die Prüfung einzubeziehen; insoweit ist im Rahmen der Prüfung lediglich festzustellen, ob diese Angaben gemacht wurden. Die Erklärung zur Unternehmensführung beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat. Wir verfolgen dabei das Ziel, die Darstellung der Unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG UND BERICHT- ERSTATTUNG ZUR CORPORATE GOVERNANCE

Gem. § 161 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten deutschen Aktiengesellschaft verpflichtet, zumindest einmal jährlich zu erklären, ob dem Deutschen Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen des Kodex nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht. Auf Basis intensiver Beratungen haben Vorstand und Aufsichtsrat am 9. Januar 2017 erklärt, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der letzten Fassung vom 5. Mai 2015 mit den folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprochen wird.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Entsprechenserklärung* veröffentlicht.

COMPLIANCE

Als international tätiges Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, durch untadeliges Verhalten das Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner zu gewinnen und zu erhalten. Die Einhaltung von Recht, Gesetz, unternehmensinternen Richtlinien und freiwillig eingegangenen Selbstverpflichtungen sowie deren Beachtung durch die Konzernunternehmen ist bei SÜSS MicroTec

wesentliche Leitungsaufgabe. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird das Thema im Unternehmen noch mehr Bedeutung erlangen und es wird für die Mitarbeiter weitere Schulungen, auch online, zum Thema Compliance geben.

Verhaltenskodex

Um ein einheitliches, vorbildliches Handeln und Verhalten zu gewährleisten, wurde für den gesamten Konzern ein Verhaltenskodex (Code of Conduct) entwickelt, der für alle Mitarbeiter des Konzerns gleichermaßen Gültigkeit besitzt und der als Leitfaden dienen soll. Der Verhaltenskodex wurde im Geschäftsjahr 2016 überarbeitet und erneut an alle Mitarbeiter des Unternehmens zwecks Anerkenntnis übermittelt. Der Verhaltenskodex definiert Mindeststandards und beinhaltet Hinweise für die Mitarbeiter zum Umgang mit und der Bewältigung von ethischen und rechtlichen Herausforderungen, die im Rahmen der täglichen Arbeit auftreten können. Verstöße werden im Interesse aller Mitarbeiter und des Unternehmens konsequent verfolgt und deren Ursachen beseitigt.

Compliance-Handbuch

Das gruppenweite Compliance-Programm wird darüber hinaus durch das Compliance-Handbuch, diverse Prozessregelungen sowie die für die jeweiligen Organe gültige Geschäftsordnung ergänzt. Das Compliance-Handbuch richtet sich an alle Mitarbeiter des Konzerns mit dem Ziel, ein korrektes und einheitliches Verhalten im Umgang mit vertraulichen Unternehmensdaten sicherzustellen. Insbesondere werden darin die gesetzlich geltenden Bestimmungen des Verbots der Marktmanipulation sowie die Vorgaben des Insiderrechts erläutert. Personen, die für SÜSS MicroTec tätig sind und bestimmungsgemäß Zugang zu Insiderinformationen haben, um ihre Aufgaben bei SÜSS MicroTec wahrnehmen zu können, werden gemäß den Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes in ein Insiderverzeichnis aufgenommen. Diese Personen werden über die sich daraus ergebenden rechtlichen Pflichten sowie über die Rechtsfolgen von Verstößen aufgeklärt. Den gesetzlichen Regelungen zum Verbot von Insidergeschäften wird darüber hinaus im Rahmen einer ergänzenden internen Insiderrichtlinie Rechnung getragen, die den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens für Organmitglieder und Mitarbeiter mit Zugang zum Managementinformationssystem innerhalb definierter Zeitfenster regelt. Das Compliance-Handbuch wurde 2016 überarbeitet und an alle Mitarbeiter zwecks Anerkenntnis übermittelt.

ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

SÜSS MicroTec unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft (AG) dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel eng zusammen, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Für ihre Arbeit haben sich Vorstand und Aufsichtsrat jeweils eine Geschäftsordnung gegeben.

AUFSICHTSRAT

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat die Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie und deren Umsetzung. Er behandelt die Quartals- und Halbjahresberichte und billigt den Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG und des Konzerns unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. Zu seinen Pflichten gehört auch die Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und der unternehmensinternen Richtlinien durch das Unternehmen (Compliance). Bedeutende Geschäftsvorgänge – wie beispielsweise Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an seine Zustimmung gebunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG besteht gemäß Satzung aus drei Mitgliedern. Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt, gehören dem Aufsichtsrat eine nach dessen Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder an. Insbesondere gehört mit Herrn Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied dem Aufsichtsrat an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet sind. Die Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre. Die laufende Amtsperiode endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2017.

Entgegen den Empfehlungen des Kodex sieht der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG von der Bildung von Ausschüssen ab. Der Aufsichtsrat, der seit Juni 2008 aus drei Mitgliedern besteht, ist vielmehr der Ansicht, dass die Bildung von Ausschüssen die Zusammenarbeit und Beschlussfindung unnötig erschweren würde.

VORSTAND

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die Führung der Geschäfte und entscheiden über Grundsatzfragen der Geschäftspolitik sowie über die Jahres- und Mehrjahresplanung. Sie entwickeln die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren Umsetzung. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Compliance.

Darüber hinaus ist der Vorstand zuständig für die Aufstellung der Quartals- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens, der Jahresabschlüsse der SÜSS MicroTec AG und der Konzernabschlüsse. Der Vorstand hat ferner für die Einhaltung von Rechtsvorschriften, behördlichen Regelungen und unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin (Compliance).

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS UND DES VORSTANDS

Die SÜSS MicroTec AG entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Vergütung für den Vorstand und den Aufsichtsrat individualisiert offenzulegen. Die Grundbezüge der Vergütungssysteme und die Vergütungen sind im Vergütungsbericht, der Teil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt. Im Hinblick auf die vom Deutschen Corporate Governance Kodex angestrebte „vertikale Vergütungsstruktur“ erklärt SÜSS MicroTec AG insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung, da der Aufsichtsrat der Auffassung ist, dass die Festlegung des obersten Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann.

AKTIENGESCHÄFTE DER ORGANMITGLIEDER (EIGENGESCHÄFTE VON FÜHRUNGSPERSONEN)

Personen, die bei der SÜSS MicroTec AG Führungsaufgaben wahrnehmen und damit insbesondere die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, sind nach Artikel 19 Marktmissbrauchsverordnung (MAR) gesetzlich verpflichtet, eigene Geschäfte mit Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten, offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 € zum Ende des Kalenderjahres nicht erreicht.

Alle meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte wurden entsprechend den gesetzlichen Regelungen veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens frei einsehbar unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Corporate Governance* > *Eigengeschäfte von Führungspersonen*. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats halten 0,56 Prozent (107.800 Stimmrechte von 19.115.538 Stimmrechten) am Grundkapital der SÜSS MicroTec AG.

FESTLEGUNG VON ZIELGRÖSSEN ZUR FÖRDERUNG DER TEILHABE VON FRAUEN AN FÜHRUNGS- POSITIONEN

Durch das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ (§ 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des AktG) sind börsennotierte Gesellschaften wie die SÜSS MicroTec AG unter anderem verpflichtet worden, erstmals Zielgrößen für den Frauenanteil in Aufsichtsrat, Vorstand und den nachfolgenden zwei Führungsebenen festzulegen. Darüber hinaus musste festgelegt werden, bis wann die jeweilige Zielgröße erreicht werden soll.

In Umsetzung der vorgenannten Verpflichtung beschloss der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von null Prozent. Damit wurde der Stand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung festgehalten, so dass sich die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG beschloss am 7. September 2015 für den Frauenanteil im Vorstand der SÜSS MicroTec AG eine Zielgröße von null Prozent. Damit wurde der Stand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung festgehalten, so dass sich auch insoweit die Festlegung einer Frist zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße erübrigte.

Für die erste und zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand der SÜSS MicroTec AG am 2. September 2015 jeweils eine Zielgröße von 20 Prozent und eine Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 beschlossen. Die Zielgröße für die erste Führungsebene bedeutet eine Steigerung des Frauenanteils, der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 18 Prozent lag. Die Zielgröße für die zweite Führungsebene bedeutet ebenso eine Steigerung, da der Frauenanteil zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bei 14 Prozent lag. Die Umsetzungsfrist schöpft den zulässigen Rahmen für die erstmalige Festlegung der Umsetzungsfrist aus. Zum 31. Dezember 2016 erhöhte sich der Frauenanteil innerhalb der ersten Führungsebene auf 24 Prozent (Vorjahr: 18 Prozent), der Frauenanteil der zweiten Führungsebene erhöhte sich auf 15 Prozent (Vorjahr 14: Prozent).

AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der SÜSS MicroTec AG üben ihre Mitbestimmungs- und Kontrollrechte auf der mindestens einmal jährlich stattfindenden Hauptversammlung aus. Jede Aktie der SÜSS MicroTec AG gewährt eine Stimme. Sämtliche für die Entscheidungsfindung notwendigen Unterlagen sind entsprechend den aktienrechtlichen Vorschriften auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und können ebenfalls in Kopie beim Unternehmen angefordert werden.

Jeder Aktionär, der im Aktienregister eingetragen ist und sich rechtzeitig anmeldet, ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, die von der Gesellschaft eingesetzten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu lassen. Weisungen zur Stimmrechtsausübung können schriftlich im Vorfeld oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt, vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat festgestellt.

Am 15. Juni 2016 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

RISIKOMANAGEMENT

Der verantwortungsbewusste Umgang mit geschäftlichen Risiken gehört zu den Grundsätzen guter Corporate Governance. Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist ein Risikomanagementsystem seit langem Bestandteil der Unternehmensführung bei SÜSS MicroTec. Dieses wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagementsystems wurde ein Risikomanagementbeauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet. Der Vorstand seinerseits informiert den Aufsichtsrat regelmäßig über bestehende Risiken und deren Entwicklung.

Einzelheiten zum Risikomanagement im SÜSS MicroTec-Konzern sind im Risikobericht, der Teil des Lageberichts ist, dargestellt. Hierin ist der gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) geforderte Bericht zum rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystem enthalten.

TRANSPARENZ

Die SÜSS MicroTec AG informiert Aktionäre, Analysten, Aktionärsvereinigungen, Medien und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die Lage des Konzerns. Die verschiedenen Zielgruppen werden dabei gleichzeitig und gleichberechtigt behandelt. Alle kapitalmarktrelevanten Informationen sind zudem auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und frei einsehbar. Die wesentlichen wiederkehrenden Termine und Ereignisse sind im Finanzkalender des Unternehmens zusammengestellt. Dieser wird mit ausreichend zeitlichem Vorlauf veröffentlicht und ist auf der Website des Unternehmens einsehbar unter www.suss.com > *Investor Relations* > *Finanzkalender*.

Vergütungsbericht

VERGÜTUNG DES VORSTANDS

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden. Aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen; darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenium beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind einzelnen Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Für die Geschäftsjahre 2012 bis 2015 betrug die variable Vergütung höchstens 150 Prozent der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres. Diese Regelung fand im Geschäftsjahr 2015 Anwendung für Herrn Knopp und Herrn Braun. Für Herrn Dr. Hansson betrug die variable Vergütung höchstens 110 Prozent der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres.

Seit dem 1. Januar 2016 kann die variable Vergütung für Herrn Knopp und Herrn Braun höchstens 100 Prozent der Festvergütung zu Beginn des Geschäftsjahres betragen. Diese Regelung findet auch für Herrn Dr. Richter Anwendung. Für den zwischenzeitlich ausgeschiedenen Herrn Dr. Hansson kann die variable Vergütung höchstens 110 Prozent der Festvergütung zu Beginn des Geschäftsjahres betragen. Die Regelungen gelten auch für künftige Geschäftsjahre.

70 Prozent der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 Prozent nach Mehrjahreszielen. Da Herr Dr. Hansson für das Geschäftsjahr 2015 eine garantierte Tantieme erhielt, wurden für ihn keine Jahresziele bzw. Mehrjahresziele vereinbart. Für das Geschäftsjahr 2016 sind die Tantiemenansprüche von Herrn Dr. Hansson mit der Abfindungszahlung abgegolten.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

70 Prozent der variablen Vergütung entfallen auf Jahresziele, die für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt werden.

Für die Geschäftsjahre 2012 bis 2015 wurden folgende Jahresziele festgelegt: Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow, wobei die Gewichtung unterschiedlich war. Ab dem Geschäftsjahr 2016 finden folgende Jahresziele Anwendung: Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Return on Investment (ROI), wobei die Gewichtung der Jahresziele unterschiedlich ist.

Werden die Jahresziele – Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow – zu 70 Prozent oder weniger und das Jahresziel ROI zu 90 Prozent oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 Prozent ist bei den Zielen Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow der Maximalbetrag erreicht, bei dem Ziel ROI bei einer Zielerreichung

von 110 Prozent. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel – Auftragseingang, Umsatz, EBITDA oder Free Cashflow – zwischen 70 Prozent und 130 Prozent, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Für das Ziel ROI liegt die Bandbreite entsprechend zwischen 90 Prozent und 110 Prozent.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrags (Vorbehaltshälfte) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrags Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARBIABLE VERGÜTUNG B)

30 Prozent der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Erstmals erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012, sodann für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015, wobei diese sich nach Funktion und Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds unterschieden. Die Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 bezogen sich auf die Erreichung festgelegter EBIT-Margen bzw. Meilensteine von Entwicklungsprojekten in definierten Zeiträumen. Wurden diese Ziele zu 70 Prozent oder weniger erreicht, entfiel diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 150 Prozent war der Maximalbetrag erreicht. Betrug der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 Prozent und 150 Prozent, war der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wurde jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

Die Ziele für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 bestehen aus einer Kombination von Umsatz und Bruttogewinnmarge (Gross-Profit-Marge) und betreffen zum einen den SÜSS MicroTec-Konzern insgesamt und zum anderen das Segment Bonder sowie die in den USA angesiedelten Produktlinien. Die Gewichtung dieser Mehrjahresziele ist unterschiedlich. Für jedes Ziel und jedes Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat unterschiedliche Zielerreichungsgrade definiert. So variieren die unteren Grenzen der Zielerreichungsgrade je nach Ziel und Geschäftsjahr zwischen 84,4 Prozent und 98,0 Prozent, die oberen Grenzen zwischen 104,1 Prozent und 115,6 Prozent. Werden die unteren Grenzen der Zielerreichungsgrade erreicht oder unterschritten, entfällt die Vergütungskomponente für das jeweilige Teilziel. Werden die oberen Grenzen der Zielerreichungsgrade erreicht oder überschritten, fällt der Maximalbetrag für das jeweilige Teilziel an. Liegt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel dazwi-

schen, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrags. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

VORSTANDSVERGÜTUNG

Die im Folgenden aufgeführten Tabellen zur Vorstandsvergütung entsprechen dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Festvergütung und die Nebenleistungen richten sich nach dem vereinbarten Festbetrag. Für die variable Vergütung ist sowohl ein Zielwert für eine Erreichung von 100 Prozent angegeben als auch die erreichbare Minimal- und Maximalvergütung.

Für das Geschäftsjahr 2015 betrug die Tantieme von Herrn Braun mindestens 35.625,00 €. Für das Geschäftsjahr 2015 erhielt Herr Dr. Hansson eine garantierte Tantieme von 186.667,00 €. Für das Geschäftsjahr 2016 sind die Tantiemenansprüche von Herrn Dr. Hansson mit der Abfindungszahlung abgegolten.

HÖHE DER VORSTANDSVERGÜTUNG

Die folgenden Tabellen („Gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“) zeigen die Vergütung für die Geschäftsjahre 2016 und 2015 je Vorstandsmitglied gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex Ziffer 4.2.5 Abs. 3.

Zielvergütung des Vorstands nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

| | | Dr. Franz Richter Vorstandsvorsitzender (CEO) Eintritt: 07.09.2016 | | | |
|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>in €</i> | | | | | |
| Gewährte Zuwendungen | | 2015 | 2016 (100%) | 2016 (Min.) | 2016 (Max.) |
| Festvergütung | | – | 114.545,45 | 114.545,45 | 114.545,45 |
| Wechselprämie ¹ | | – | – | – | – |
| Nebenleistungen (fix) ² | | – | 10.570,08 | 10.570,08 | 10.570,08 |
| Aufwand für Altersversorgung ³ | | – | – | – | – |
| Summe | | – | 125.115,53 | 125.115,53 | 125.115,53 |
| Einjährige variable Vergütung (A) ⁴ | | – | 39.550,00 | – | 79.100,00 |
| davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵ | | – | 19.775,00 | – | 39.550,00 |
| Mehrjährige variable Vergütung (B) 2013–2015 und 2016–2018 | | – | 16.950,00 | – | 33.900,00 |
| Summe | | – | 181.615,53 | 125.115,53 | 238.115,53 |
| Versorgungsaufwand | | – | – | – | – |
| Gesamtvergütung | | – | 181.615,53 | 125.115,53 | 238.115,53 |

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kam in zwei Tranchen zur Auszahlung: im Mai 2015 und im Mai 2016.

² Enthält:

Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
geldwerter Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

| | | Michael Knopp Finanzvorstand (CFO) | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>in €</i> | | | | | |
| Gewährte Zuwendungen | | 2015 | 2016 (100%) | 2016 (Min.) | 2016 (Max.) |
| Festvergütung | | 268.339,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Wechselprämie ¹ | | – | – | – | – |
| Nebenleistungen (fix) ² | | 21.646,08 | 22.052,84 | 22.052,84 | 22.052,84 |
| Aufwand für Altersversorgung ³ | | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 |
| Summe | | 292.133,08 | 304.200,84 | 304.200,84 | 304.200,84 |
| Einjährige variable Vergütung (A) ⁴ | | 136.500,00 | 98.000,00 | – | 196.000,00 |
| davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵ | | 68.250,00 | 49.000,00 | – | 98.000,00 |
| Mehrjährige variable Vergütung (B) 2013–2015 und 2016–2018 | | 58.500,00 | 42.000,00 | – | 84.000,00 |
| Summe | | 487.133,08 | 444.200,84 | 304.200,84 | 584.200,84 |
| Versorgungsaufwand | | – | – | – | – |
| Gesamtvergütung | | 487.133,08 | 444.200,84 | 304.200,84 | 584.200,84 |

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kam in zwei Tranchen zur Auszahlung: im Mai 2015 und im Mai 2016.

² Enthält:

Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
geldwerter Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung
Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

| in € | Walter Braun Produktionsvorstand (COO) | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 (100%) | 2016 (Min.) | 2016 (Max.) |
| Gewährte Zuwendungen | | | | |
| Festvergütung | 189.996,00 | 230.004,00 | 230.004,00 | 230.004,00 |
| Wechselprämie ¹ | – | – | – | – |
| Nebenleistungen (fix) ² | 20.093,88 | 19.146,84 | 19.146,84 | 19.146,84 |
| Aufwand für Altersversorgung ³ | – | – | – | – |
| Summe | 210.089,88 | 249.150,84 | 249.150,84 | 249.150,84 |
| Einjährige variable Vergütung (A) ⁴ | 99.750,00 | 80.500,00 | – | 161.000,00 |
| davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵ | 49.875,00 | 40.250,00 | – | 80.500,00 |
| Mehrjährige variable Vergütung (B) 2013–2015 und 2016–2018 | 42.750,00 | 34.500,00 | – | 69.000,00 |
| Summe | 352.589,88 | 364.150,84 | 249.150,84 | 479.150,84 |
| Versorgungsaufwand | – | – | – | – |
| Gesamtvergütung | 352.589,88 | 364.150,84 | 249.150,84 | 479.150,84 |

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kam in zwei Tranchen zur Auszahlung: im Mai 2015 und im Mai 2016.

² Enthält:

- Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
- geldwerter Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
- Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung
- Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

| in € | Dr. Per-Ove Hansson Vorstandsvorsitzender (CEO) Austritt: 16.08.2016 | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 (100 %) | 2016 (Min.) | 2016 (Max.) |
| Gewährte Zuwendungen | | | | |
| Festvergütung | 233.336,00 | 356.668,00 | 356.668,00 | 356.668,00 |
| Wechselprämie ¹ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Nebenleistungen (fix) ² | 44.850,10 | 24.579,60 | 24.579,60 | 24.579,60 |
| Aufwand für Altersversorgung ³ | – | – | – | – |
| Summe | 378.186,10 | 481.247,60 | 481.247,60 | 481.247,60 |
| Einjährige variable Vergütung (A) ⁴ | 130.666,90 | 196.000,00 | – | 269.500,00 |
| davon Investitionen in SÜSS MicroTec-Aktien ⁵ | 65.333,45 | 98.000,00 | – | 134.750,00 |
| Mehrjährige variable Vergütung (B) 2013–2015 und 2016–2018 | 56.000,10 | 84.000,00 | – | 115.500,00 |
| Summe | 564.853,10 | 761.247,60 | 481.247,60 | 866.247,60 |
| Versorgungsaufwand | – | – | – | – |
| Gesamtvergütung | 564.853,10 | 761.247,60 | 481.247,60 | 866.247,60 |

¹ Die Wechselprämie von 200.000 € kam in zwei Tranchen zur Auszahlung: im Mai 2015 und im Mai 2016.

² Enthält:

- Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
- geldwerter Vorteil Pkw bzw. Fahrzeugpauschale
- Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenversicherung
- Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

⁴ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁵ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

| in € | Dr. Franz Richter Vorstandsvorsitzender (CEO) Eintritt: 07.09.2016 | | Michael Knopp Finanzvorstand (CFO) | |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Zufluss | | | | |
| Festvergütung | – | 114.545,45 | 268.339,00 | 280.000,00 |
| Wechselprämie ¹ | – | – | – | – |
| Nebenleistungen (fix) ² | – | 10.570,08 | 21.646,08 | 22.052,84 |
| Aufwand für Altersversorgung ³ | – | – | 2.148,00 | 2.148,00 |
| Abfindungszahlungen ⁴ | – | – | – | – |
| Summe | – | 125.115,53 | 292.133,08 | 304.200,84 |
| Einjährige variable Vergütung (A) ⁵ | – | 31.451,17 | 252.429,75 | 77.932,11 |
| davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien ⁶ | – | 15.725,59 | 126.214,87 | 38.966,06 |
| Mehrjährige variable Vergütung (B) 2013–2015 und 2016–2018 | – | 12.631,85 | – | 31.300,14 |
| Summe | – | 169.198,55 | 544.562,83 | 413.433,09 |
| Versorgungsaufwand | – | – | – | – |
| Gesamtvergütung | – | 169.198,55 | 544.562,83 | 413.433,09 |

¹ Die Wechselprämie von 200.000 Euro kam in zwei Tranchen zur Auszahlung: im Mai 2015 und im Mai 2016.

² Enthält:

- Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
- Geldwerter Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale
- Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
- Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

⁴ Abgeltung für Aufhebung Dienstvertrag (urspr. Restlaufzeit bis 30.04.2018) und Bonus 2016

⁵ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁶ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

| in € | Walter Braun Produktionsvorstand (COO) | | Dr. Per-Ove Hansson Vorstandsvorsitzender (CEO) Austritt: 16.08.2016 | |
|--|---|-------------------|--|---------------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Zufluss | | | | |
| Festvergütung | 189.996,00 | 230.004,00 | 233.336,00 | 356.668,00 |
| Wechselprämie ¹ | – | – | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Nebenleistungen (fix) ² | 20.093,88 | 19.146,84 | 44.850,10 | 24.579,60 |
| Aufwand für Altersversorgung ³ | – | – | – | – |
| Abfindungszahlungen ⁴ | – | – | – | 750.000,00 |
| Summe | 210.089,88 | 249.150,84 | 378.186,10 | 1.231.247,60 |
| Einjährige variable Vergütung (A) ⁵ | 184.467,89 | 64.015,66 | 130.666,90 | – |
| davon Investition in SÜSS MicroTec -Aktien ⁶ | 92.233,95 | 32.007,83 | 65.333,45 | – |
| Mehrjährige variable Vergütung (B) 2013–2015 und 2016–2018 | 64.125,00 | 25.710,83 | 56.000,10 | – |
| Summe | 458.682,77 | 338.877,33 | 564.853,10 | 1.231.247,60 |
| Versorgungsaufwand | – | – | – | – |
| Gesamtvergütung | 458.682,77 | 338.877,33 | 564.853,10 | 1.231.247,60 |

¹ Die Wechselprämie von 200.000 Euro kam in zwei Tranchen zur Auszahlung: im Mai 2015 und im Mai 2016.

² Enthält:

- Zuschuss freiwillige Rentenversicherung
- Geldwerter Vorteil PKW bzw. Fahrzeugpauschale
- Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
- Zuschuss Umzug und Mehrkosten Wohnung (befristet auf sechs Monate)

³ Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung).

⁴ Abgeltung für Aufhebung Dienstvertrag (urspr. Restlaufzeit bis 30.04.2018) und Bonus 2016

⁵ Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 Prozent der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres.

⁶ Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsverpflichtungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands.

VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 2.000,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an seiner Verantwortung und seinem Tätigkeitsumfang orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 60.000,00 €, sein Stellvertreter 50.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 45.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

| 2016 in € | Vergütung | Sitzungsgeld | Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie |
|--|-----------|--------------|--|
| Aufsichtsrat | | | |
| Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender) | 60.000,00 | 16.000,00 | 1.655,18 |
| Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) | 50.000,00 | 16.000,00 | 827,59 |
| Gerhard Pegam | 45.000,00 | 16.000,00 | 551,73 |

| 2015 in € | Vergütung | Sitzungsgeld | Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie |
|--|-----------|--------------|--|
| Aufsichtsrat | | | |
| Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender) | 60.000,00 | 12.000,00 | 1.655,18 |
| Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) | 50.000,00 | 12.000,00 | 827,59 |
| Gerhard Pegam | 45.000,00 | 12.000,00 | 551,73 |

Im Geschäftsjahr 2016 haben weder die Mitglieder des Aufsichtsrats noch ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung des SÜSS MicroTec-Konzerns

Unser Chancen- und Risikomanagement zielt darauf ab, den Unternehmenswert des SÜSS MicroTec-Konzerns nachhaltig zu sichern und zu steigern. Zu unserer unternehmerischen Zielsetzung gehören das frühzeitige und erfolgreiche Erkennen von Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion darauf. Die vielfältigen Chancen für unseren Konzern resultieren aus der Technologieführerschaft in unseren Geschäftsfeldern, unserem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen für die Halbleiter-Equipment-Industrie, den Kooperationen mit internationalen Kunden und Forschungsinstituten sowie unserer globalen Ausrichtung.

Chancen und Risiken definieren wir wie folgt:

- Chancen sind mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.
- Unter Risiken verstehen wir mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Analyse und Beurteilung der Chancen und Risiken des Konzerns ist Gegenstand fortlaufender Betrachtungen durch den Vorstand und das Management des Konzerns. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

CHANCEN DES KONZERNS

Die globale Geschäftstätigkeit des SÜSS MicroTec-Konzerns innerhalb eines dynamischen Marktumfelds eröffnet ständig neue Chancen, die das angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec unterstützen und vorantreiben können. Das Erkennen und Nutzen dieser Chancen gehört daher zu den wesentlichen Bestandteilen unserer Wachstumspolitik.

Gesamtwirtschaftliche Chancen

SÜSS MicroTec ist mit Produktions-, Verkaufs- und Serviceniederlassungen weltweit vertreten und arbeitet darüber hinaus mit vielen externen Handelspartnern zusammen. Durch die internationale Präsenz bieten sich dem Konzern zahlreiche Chancen, weltweit neue Kunden zu akquirieren, neue Kooperationen einzugehen und an dem Wachstum der Industriemärkte in den bedeutenden und aufstrebenden Volkswirtschaften teilzuhaben.

Unternehmensstrategische Chancen

SÜSS MicroTec hat in der Herstellung von Prozessausrüstungen für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereitzustellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht. Diese Stärken zusammen mit einer soliden finanziellen Ausstattung geben dem Konzern die Möglichkeit, aussichtsreiche Entwicklungsprojekte durchzuführen, erfolgversprechende Kooperationen einzugehen und damit die Produktpalette weiter auszubauen sowie Anwendungen und Technologien weiterzuentwickeln. Der SÜSS MicroTec-Konzern pflegt zahlreiche Entwicklungspartnerschaften mit Forschungsinstituten und Universitäten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bietet großes Potenzial für SÜSS MicroTec, denn diese arbeiten in der Regel sehr eng mit unseren Kunden zusammen und werden zu einem nicht unerheblichen Anteil durch die Kunden finanziert. Neue Basistechnologien werden häufig in den Laboren der Forschungsinstitute entwickelt und finden dann erst ihren Weg in die Industrie. Umso wichtiger ist es für ein Hightech-Unternehmen wie SÜSS MicroTec, von Anfang an in die Neuentwicklung von Technologien und Prozessen miteingebunden zu sein. Dies erhöht die Chancen, später Maschinen und Lösungen für das industrielle Umfeld in der Volumenproduktion liefern zu können.

Neben der Weiterentwicklung eigener Technologien sieht SÜSS MicroTec grundsätzlich auch die Chance, den Konzern durch Akquisition von außen um neue Geschäftsfelder und Technologien zu erweitern.

Branchen- und marktspezifische Chancen

Grenzenlose Mobilität, moderne Medizin, Kommunikation im Internet of Things – all das wäre ohne leistungsfähige Chips nicht denkbar. Die technisch anspruchsvolle Fertigung dieser Chips erfolgt in mehreren komplexen Bearbeitungsschritten (Mikrostrukturierung), wofür die Chiphersteller entsprechende Spezialmaschinen benötigen. Diese Spezialmaschinen entwickelt und baut SÜSS MicroTec.

Die von SÜSS MicroTec bedienten Märkte der Halbleiter-Equipment-Industrie unterliegen einem stetigen Wandel, der vor allem durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beeinflusst wird. Die Anzahl der weltweiten Internetnutzer zeigt einen stetigen Anstieg. So wurden im Jahr 2014 rund 2,95 Mrd. Internetnutzer gezählt, das entsprach rund 41,1 Prozent der Weltbevölkerung. Für das Jahr 2016 wird von rund 3,43 Mrd. Internetnutzern ausgegangen, was einem Anteil an der Weltbevölkerung von ca. 46,8 Prozent entspricht.¹ Für die Folgejahre wird ein weiterer Anstieg unterstellt. Die Prognosen gehen von ca. 4,17 Mrd. Internetnutzern im Jahr 2020 aus.²

Auch die Anzahl der weltweiten Smartphone- und Tablet-User zeigt weiterhin einen Zuwachs: So wurden im Jahr 2014 rund 1,57 Mrd. Smartphone-User und 0,86 Mrd. Tablet-User gezählt. Für das Jahr 2016 wird von rund 2,10 Mrd. Smartphone-Usern (ca. 28,7 Prozent der Weltbevölkerung) und 1,12 Mrd. Tablet-Usern (ca. 15,0 Prozent der Weltbevölkerung) ausgegangen.² 2020 wird die Anzahl der Smartphone- und Tablet-User – aktuellen Prognosen zufolge – rund 2,87 Mrd. bzw. 1,46 Mrd. weltweit betragen.

Am 27. Februar 2017 startete in Barcelona der Mobile World Congress, die weltweit größte Messe rund um den Mobilfunk. Die Themen, die beim Mobile World Congress im Fokus standen, lassen auf die für die kommenden Jahre zu erwartenden Entwicklungen im Mobilfunkbereich schließen. Für 2017 wurde die Vorstellung von immer leistungsfähigeren Smartphones und Tablets zahlreicher namhafter Hersteller erwartet. Darüber hinaus spielte das Thema Mobile Wear eine große Rolle: Verschiedene Anbieter haben die Einführung neuer Modelle von Smartwatches und Fitnessstrackern angekündigt. Zu den Themen Virtual Reality und Augmented Reality wurden ebenfalls Neuheiten und Weiterentwicklungen erwartet. Für die Bereiche Internet of Things und Smart Home, also die Vernetzung aller Geräte im Alltag, stand die Vorstellung neuester Techniken von verschiedenen Anbietern auf dem Programm. Nicht zuletzt gehörte der Ausbau des Mobilfunknetzes auf den Netzstandard 5G zu den zentralen Themen des Mobile World Congress.

Die zunehmende Nachfrage nach Smartphones, Tablets und Wearables mit komplexen Bauteilen fördert den Umsatz von SÜSS MicroTec bei mehreren Produkten. Unsere Mask-Aligner, Belacker und Bonder werden von unseren Kunden eingesetzt, um Chips mit Strukturen zu versehen und um zahlreiche Sensoren, die in jedem Smartphone enthalten sind, herzustellen.

Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten SÜSS MicroTec – je nach Art der Entwicklung – zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftrags-eingänge und der Umsätze sorgen können.

Unser globales Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern, Produkt-ingenieuren und Handelspartnern ist darauf ausgerichtet, die branchen- und marktspezifischen Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen. SÜSS MicroTec ist in den Kernmärkten der Halbleiter-Equipment-Industrie in Taiwan, China, Singapur, Südkorea und Japan mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Unsere Niederlassungen pflegen stets den direkten Kontakt mit unseren Kunden und haben damit die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen auf den Halbleitermärkten umgehend zu registrieren. Damit kann SÜSS MicroTec rasch auf sich abzeichnende Neuentwicklungen reagieren und seine Anwendungen entsprechend anpassen.

Um neue Entwicklungen am Markt immer schnell wahrzunehmen, ist uns der direkte und regelmäßige Kontakt zu Kooperationspartnern, Kunden und potenziellen Neukunden sehr wichtig. SÜSS MicroTec ist daher auf Messen für die Halbleiterindustrie vertreten und veranstaltet internationale Technologieforen.

So stellt SÜSS MicroTec seine Neuentwicklungen regelmäßig auf den SEMICON-Messen vor, die jährlich an verschiedenen Standorten weltweit stattfinden. In 2016 war SÜSS MicroTec auf den SEMICON-Messen in Korea (Seoul), China (Shanghai), Taiwan (Taipei) und Europa (Grenoble, Frankreich) vertreten und hat die neuesten Technologien der verschiedenen Produktlinien präsentiert. Auf allen Messen konnten zahlreiche Besuche von Kunden und Interessenten verzeichnet werden. Parallel zur SEMICON China nahm SÜSS MicroTec auch auf der Laser World of Photonics CHINA teil, die ebenfalls in Shanghai stattfand. Auf dieser Messe werden regelmäßig die neuesten Anwendungen und Technologien der Laser- und Photonikindustrie vorgestellt. SÜSS MicroTec präsentierte seine Produkte unter anderem auf mehreren kleinen Messen und Konferenzen, wie etwa der IEEE Electronic Components and Technology Conference (ECTC) in Lake Buena Vista oder der International Wafer-Level Packaging Conference, die in Santa Clara, USA, stattfand. Zudem organisierte SÜSS MicroTec Kundenworkshops, wie etwa den Photomask-Equipment-Summit während der SPIE Photomask Technology (PE) in Monterey, USA. Hier trafen sich Schlüsselkunden aus der Industrie, um zusammen mit SÜSS MicroTec Roadmaps und zukünftige Entwicklungen zu diskutieren.

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Branchenverband SEMI und zahlreichen internationalen Forschungsinstituten kann SÜSS MicroTec einen großen Adressatenkreis ansprechen. Die internationale Präsenz von SÜSS MicroTec und der durch die Messen und Veranstaltungen hohe Bekanntheitsgrad geben uns die Möglichkeit, das Ohr immer direkt am Markt zu haben und auf technologische Fortschritte und Neuentwicklungen schnell zu reagieren.

¹ Quelle: eMarketer, April 2016. Berücksichtigt wurden Internetnutzer jeden Alters, die das Internet – ohne Berücksichtigung des Standorts bzw. des Geräts – mindestens einmal im Monat nutzen.

² Quelle: eMarketer, April 2016.

Operative Chancen

Die Lithografie ist nach wie vor der größte Umsatzbringer der SÜSS MicroTec-Gruppe und sorgt jährlich für etwa zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Mit den Produktlinien Mask-Aligner und Belacker/Entwickler ist SÜSS MicroTec seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten und bedient damit Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten. Das konstante Umsatzvolumen und die relativ stabilen Margen dieser beiden Produktlinien sichern dem SÜSS MicroTec-Konzern eine gleichmäßige Auslastung der Produktionsstandorte Garching und Sternenfels und beständige positive Cashflows. Mit Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Technologien dieser beiden Produktlinien festigen wir unsere Marktposition und stellen sicher, dass mit Mask-Alignern und Belackern/Entwicklern auch zukünftig stabile Margen und Cashflows erzielt werden können.

Die Technologien der SÜSS MicroTec Photonic Systems – die UV-Projektionsbelichtung und die Laserprozessierung – ergänzen und erweitern unser Produktportfolio im Bereich Lithografie. Im Jahr 2015 konnten wir einen Großauftrag eines führenden Herstellers der Halbleiterindustrie über eine nennenswerte Stückzahl von Projektionsscannern des Typs DSC300 Gen2 verbuchen. Die Geräte sind für die Serienfertigung im Wachstumssegment Fan-out-Wafer-Level-Packaging vorgesehen. Die DSC300 Gen2 bietet vergleichbare Fähigkeiten im Hinblick auf Auflösung und Overlay bei gleichzeitig höherem Durchsatz und damit geringere Kosten als herkömmliche Projektionsstepper. In 2016 haben wir für alle ausgelieferten Projektionsscanner die Abnahme durch den Kunden erhalten und damit den Umsatz realisiert. Wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen, könnten wir auch in den kommenden Jahren weiter substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze mit Scannern erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

Das Segment Bonder untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden gegenüber 2015 insbesondere in der Produktlinie permanentes Bonden deutlich mehr Aufträge erzielt. Positiv wirkte sich hier die Markteinführung der XB8 im dritten Quartal 2015 aus. Nach zunächst zögerlichem Markteintritt bestellten die Kunden in der zweiten Jahreshälfte 2016 eine größere Anzahl von Maschinen des Typs XB8. Zudem konnten in der Produktlinie temporäres Bonden neue Aufträge und Kunden gewonnen werden. Für die Zukunft erwarten wir in diesem Bereich weiterhin steigende Auftragseingänge und Umsätze sowie langfristig positive Margen, insbesondere durch die Einführung neuer Produkte, wie beispielsweise den neuen automatischen Bonder XBS200 sowie den Ausbau von Marktanteilen bei der MEMS- und LED-Herstellung.

Im Segment Fotomasken-Equipment haben wir seit der Akquisition der SÜSS MicroTec Photomask Equipment im Jahr 2010 hohe Umsätze und hohe Margen erzielt. Der Großteil der Umsätze wurde mit wenigen Einzelaufträgen erzielt, die jeweils einen sehr hohen Auftragswert von mehreren Millionen Euro aufwiesen. Die Umsätze pro Geschäftsjahr weisen daher große Schwankungen

auf. In diesem Segment sehen wir unsere Marktposition als sehr gefestigt an und gehen davon aus, auch in Zukunft hohe Gewinne zu erzielen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich langfristig weiterhin starke Schwankungen im Umsatz pro Geschäftsjahr ergeben werden, was sich entsprechend auf das Segmentergebnis pro Geschäftsjahr auswirken kann.

Das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz, hat sich auch im Jahr 2016 sehr positiv entwickelt. Im MicroOptics-Geschäft konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzsteigerungen von rund 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Im Jahr 2016 wurden weitere Investitionen in Maschinen und technische Anlagen vorgenommen, um der guten Auftragslage Rechnung zu tragen. Für die kommenden Jahre erwarten wir weitere Umsatzsteigerungen im MicroOptics-Geschäft und gehen davon aus, dass die SÜSS MicroOptics in Zukunft einen substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis leisten wird.

Finanzielle Chancen

Starke Veränderungen am Währungsmarkt können den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der momentan gegenüber dem US-Dollar eher schwach notierende Euro bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der Kurs des japanischen Yen im Vergleich zum Euro unterlag im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut starken Schwankungen. Während der japanische Yen zu Jahresbeginn 2016 noch bei 131,13 Yen für einen Euro notierte, lag der Kurs zum 31. Dezember 2016 bei 123,49 Yen pro Euro. In den Monaten August und September 2016 waren Kurse von ca. 112,90 Yen für einen Euro zu verzeichnen. 2017 setzte sich diese volatile Entwicklung fort, so dass der japanische Yen Mitte Februar 2017 teilweise deutlich unter 120 Yen pro Euro notierte. Der momentan starke Yen-Kurs könnte die Verkaufszahlen diverser japanischer Wettbewerber, die vor allem im Markt für Belacker aktiv sind, negativ beeinflussen oder bei diesen Wettbewerbern für deutliche Margeneinbußen sorgen. Sollte die Stärke des japanischen Yen anhalten oder der Yen noch weiter aufwerten, sehen wir gute Chancen, Marktanteile von japanischen Wettbewerbern zu gewinnen und Margenverluste, die wir im Wettbewerb mit japanischen Anbietern hinnehmen mussten, wieder zu kompensieren.

Mitarbeiterspezifische Chancen

SÜSS MicroTec sieht sich selbst als mittelständisches Unternehmen, das aufgrund der relativ geringen Unternehmensgröße flache Hierarchien aufweist und so seinen Mitarbeitern in allen Belangen kurze Kommunikationswege und schnelle Entscheidungsprozesse ermöglicht. Unsere mittelständischen Strukturen in Verbindung mit unserer internationalen Ausrichtung machen SÜSS MicroTec zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit unserer weltweit tätigen Mitarbeiter beläuft sich auf beinahe zehn Jahre. Damit zeigen unsere Bemühungen, unseren Mitarbeitern ein gutes Betriebsklima, interessante Aufgaben und eine attraktive Vergütung zu bieten, ihren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass wir auch zukünftig alle freien Stellen mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern werden besetzen können. Unsere bisherige Strategie, langjährige Mitarbeiter zu halten, werden wir unverändert fortsetzen.

Unser Vergütungssystem beinhaltet für unsere Führungskräfte eine variable Vergütung, deren Höhe sich nach dem Grad der Zielerreichung richtet. Die Ziele werden jährlich neu definiert und basieren auf bestimmten Kenngrößen des Konzerns (wie zum Beispiel EBITDA, Umsatz und Auftragseingang), die anhand der aktuellen Budgetplanung jährlich neu festgelegt werden. Zusätzlich werden mit dem Mitarbeiter persönliche Ziele vereinbart. Für die Mitarbeiter des Vertriebs werden in der Regel Ziele definiert, die im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kundenaufträgen stehen. Die persönlichen Ziele von Mitarbeitern anderer Abteilungen haben meist Leistungen oder Projekte zum Inhalt, die einen Zusatznutzen für den jeweiligen Fachbereich mit sich bringen. Durch die Einbindung der Budgetplanung in das Vergütungssystem setzen wir für unsere Führungskräfte einen finanziellen Anreiz, aktiv dazu beizutragen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Damit erhöhen wir unsere Chancen, unseren geplanten Umsatz und unser geplantes Ergebnis tatsächlich zu erzielen. Die Definition von persönlichen Zielen für die Führungskräfte bietet uns darüber hinaus die Chance, zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen umzusetzen, auch wenn dafür ein Arbeitseinsatz der Mitarbeiter notwendig ist, der über das normale Tagesgeschäft hinausgeht.

Als weltweit erfolgreiches Technologieunternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, neue Produktentwicklungen gezielt vorantreiben, um so den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen. SÜSS MicroTec setzt hierzu die entsprechenden Anreize und vergütet Ideen der Mitarbeiter, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen, mit einer jährlich auszuzahlenden Erfindervergütung.

Unsere internationale Präsenz ermöglicht es uns, hochqualifizierte Mitarbeiter weltweit anzuwerben, wenn es aktuelle Entwicklungen erforderlich machen.

Entwicklungsspezifische Chancen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Entwicklungsaktivitäten weiter ausgebaut und unsere Mitarbeiterzahl in diesem Bereich weiter erhöht. Mehrere Entwicklungsprojekte für unsere Produktlinien Mask-Aligner und Belacker / Entwickler sowie Bonder und Fotomaskenreinigung wurden erfolgreich zum Abschluss gebracht. Bei den Produktlinien Mask-Aligner und Belacker / Entwickler lagen die Schwerpunkte vor allem auf einer verbesserten Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit unserer Maschinen und der darin verwendeten Bauteile. In den Bereichen permanentes und temporäres Bonden sowie in der Fotomaskenreinigung konnten zahlreiche Verbesserungen sowie neue Technologien eingeführt werden.

Wir werden unsere Anstrengungen auch im kommenden Jahr fortsetzen und die Schwerpunkte weiter auf Kosteneffizienz und Umweltverträglichkeit sowie die Entwicklung neuer und die Verbesserung bestehender Technologien legen. Unser Ziel ist es, unsere Produktlinien an die neuesten Entwicklungen im Markt anzupassen und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Damit wollen wir unsere Marktposition festigen und weiter ausbauen.

RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagementsystem seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagementsystems wurde ein Risikomanagementbeauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Extern wird das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft. Er berichtet darüber an Vorstand und Aufsichtsrat.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses werden vierteljährlich sämtliche identifizierten Risiken mit Hilfe einer intranetbasierten IT-Lösung erfasst und bewertet. Anschließend werden Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagementbeauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Die Aufbereitung der Informationen erfolgt durch den Risikomanagementbeauftragten, der an den Vorstand berichtet. Die Ergebnisse des Gesamtprozesses werden dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich präsentiert.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, wobei auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikokategorien eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Grad der Auswirkung bestimmt, welche Risikokategorien aus Konzernsicht als wesentlich zu betrachten sind. Hierbei wird unterschieden in geringe (grün), mittlere (gelb) und hohe (rot) Risiken.

Entsprechend unserer Methode zur Risikobewertung werden nur die hohen Risiken als wesentlich eingestuft.

| | | | Eintrittswahrscheinlichkeit | | | | |
|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch |
| | | | > 0% bis ≤ 5% | > 5% bis ≤ 10% | > 10% bis ≤ 25% | > 25% bis ≤ 50% | > 50% bis ≤ 100% |
| Auswirkung | bestandsgefährdend | > 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. € | | | | | |
| | schwerwiegend | > 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. € | | | | | |
| | bedeutend | > 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. € | | | | | |
| | moderat | > 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. € | | | | | |
| | vertretbar | 0 € bis ≤ 20 Tsd. € | | | | | |

gering
mittel
hoch

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelkonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte rechnungslegungsbezogene interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2016 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Das Bilanzierungshandbuch basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards und wird von allen Konzerngesellschaften beim Rechnungslegungsprozess zugrunde gelegt. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu, Taiwan verwendet. 2011 wurde SAP bei der SÜSS MicroTec, Inc., Corona, Kalifornien, USA, implementiert. 2015 wurde die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc., Kalifornien, USA, an das konzernweite SAP-System angeschlossen. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssysteme „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden über ein zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf Konzernebene werden innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurückberichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

RISIKEN DES KONZERNES

Gesamtwirtschaftliche Risiken

SÜSS MicroTec ist weltweit vertreten, weist eine breite Kundenstruktur auf und bietet seinen Kunden sieben unterschiedliche Produktlinien an, die in verschiedenen Branchen und Industriezweigen eingesetzt werden können. Damit ist SÜSS MicroTec grundsätzlich weder von einzelnen Märkten noch von einzelnen Abnehmern abhängig. Konjunkturelle Einbrüche in einer Region oder Branche können somit zumindest teilweise aufgefangen werden. Dank der flexiblen Aufstellung wäre SÜSS MicroTec bei größeren konjunkturellen Verwerfungen in der Lage, unverzüglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren und die Kostenstrukturen in angemessener Zeit anzupassen. Als Instrumente stehen Gleitzeitkonten, der Einsatz von Zeitarbeitskräften sowie Outsourcing-Maßnahmen zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Option, Kurzarbeit zu beantragen. Zudem werden von den Einkaufsabteilungen regelmäßig die Beschaffungsmengen überprüft und angepasst.

Politische Entscheidungen, neue Gesetzgebungen und sonstige Regularien in den Ländern, in denen SÜSS MicroTec tätig ist, können unser Geschäft negativ beeinflussen. Dazu gehören die Steuergesetzgebung in den jeweiligen Ländern, Exportbeschränkungen sowie Verschärfungen in den Bereichen Produkthaftung, Wettbewerbsrecht, Arbeitssicherheit und Patent- und Markenrecht.

SÜSS MicroTec nimmt regelmäßig an öffentlichen Ausschreibungen teil und zählt zum Beispiel Universitäten und staatliche Forschungseinrichtungen weltweit zu seinen Kunden. Die Regelungen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die Kriterien für die Vergabe unterscheiden sich je nach Land und können das Gewinnen von öffentlichen Aufträgen und deren Abwicklung deutlich erschweren.

Generell können starke Veränderungen am Währungsmarkt den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Der momentan im Vergleich zum US-Dollar schwach notierende Euro bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Der im Vergleich zum Euro stark notierende Schweizer Franken hat keine spürbaren Auswirkungen auf das Bestellverhalten unserer Kunden in den Segmenten Lithografie, Bonder und Fotomaschinen-Equipment. Allerdings ist das Geschäft der SÜSS MicroOptics S.A., die in Hauterive, Schweiz, angesiedelt ist und Mikrolinsen herstellt, stark vom Wechselkurs des Schweizer Frankens beeinflusst. Jedoch zeigt sich, dass sich das Geschäft der SÜSS MicroOptics trotz des starken Schweizer Frankens weiterhin sehr positiv entwickelt und von Umsatzzuwächsen und starken Margen geprägt ist. Wir gehen davon aus, dass die SÜSS MicroOptics zukünftig einen wesentlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis leisten wird.

Der SÜSS MicroTec-Konzern wickelt nur in sehr geringem Umfang Geschäfte in asiatischen Währungen (taiwanesischer Dollar, Singapur-Dollar, südkoreanischer Won und chinesischer Renminbi) ab. Die in Taiwan, Singapur, Südkorea und China ansässigen Tochtergesellschaften des Konzerns weisen jedoch in Euro dotierte Forderungen gegen Kunden und andere SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus. Je nach Umfang und Fälligkeit können aus der Bewertung dieser Forderungen in der jeweiligen Landeswährung signifikante Währungsverluste im Konzern entstehen.

Am 23. Juni 2016 haben die Bürger Großbritanniens mehrheitlich für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Für SÜSS MicroTec werden sich daraus keine spürbaren Auswirkungen ergeben. SÜSS MicroTec erzielte in 2016 mit Kunden aus Großbritannien einen Umsatzanteil von unter einem Prozent. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich aus einem Austritt Großbritanniens

aus der Europäischen Union negative Auswirkungen für SÜSS MicroTec ergeben werden.

Branchen- und marktspezifische Risiken

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Ein starker Einbruch des gesamten Halbleitermarktes würde bei SÜSS MicroTec Umsatzrückgänge nach sich ziehen und das Unternehmensergebnis schmälern. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

Mitarbeiterspezifische Risiken

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

Entwicklungsspezifische Risiken

Das Geschäftsmodell der SÜSS MicroTec-Gruppe basiert auf seiner starken Innovationskultur und Technologieführerschaft. Als Hersteller von Spezialmaschinen liefert SÜSS MicroTec kundenspezifische Lösungen und richtet seine Produktpolitik nach den sich schnell verändernden Bedingungen im Halbleiter-Equipment-Markt. Trotzdem sehen wir das Risiko, dass in Einzelfällen unsere technischen Entwicklungen die Vorstellungen der Märkte und unserer Kunden verfehlen könnten. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass sich die betroffenen Kunden von SÜSS MicroTec abwenden und alternative technische Lösungen bei unseren Konkurrenten suchen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben unsere Ingenieure für alle Produktlinien neue Technologien entwickelt und zahlreiche Detailverbesserungen an bestehenden Technologien vorgenommen. Von unseren Kunden haben wir hierzu sehr positive Reaktionen erhalten, die sich im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits in Form von erhöhten Auftragsengängen gezeigt haben.

Neben der Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen arbeiten die Ingenieure der SÜSS MicroTec-Gruppe permanent an langfristigen Entwicklungsprojekten, die zukünftige Entwicklungen der Märkte antizipieren sollen, damit die Produkte von SÜSS MicroTec auch in Zukunft aktuelle technische Anforderungen erfüllen werden. Es besteht das Risiko, dass einzelne Entwicklungsprojekte nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder das erzielte Ergebnis nicht die Erwartungen der Märkte trifft. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass SÜSS MicroTec auf dem angestrebten Markt zeitweise kein innovatives Produkt anbieten kann. Die betroffenen Kunden könnten sich von SÜSS MicroTec abwenden und Alternativen am Markt suchen. Zudem hätte SÜSS MicroTec knappe Ressourcen im Bereich Entwicklung ungünstig eingesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns verstärkt auf Projekte konzentriert, von denen wir glauben, dass sie bei unseren

Kunden auf positive Resonanz stoßen werden. Dazu gehörten Entwicklungen im Zusammenhang mit einem kosteneffizienteren und umweltfreundlicheren Betrieb unserer Maschinen, Neuentwicklungen von Technologien in allen Produktlinien und Verbesserungen der auf unseren Maschinen eingesetzten Software. Hierfür haben wir die Zusammenarbeit zwischen unseren Ingenieuren und den asiatischen Vertriebsgesellschaften weiter intensiviert. Die Reaktion unserer bestehenden Kunden und das Interesse potenzieller Neukunden haben uns gezeigt, dass wir damit sehr genau auf deren Vorstellungen eingehen konnten.

Für einige unserer Produkte sehen wir uns als Marktführer, da wir mit technologisch hochwertigen Lösungen die Anforderungen unserer Kunden passgenau erfüllen. Um diese Marktführerschaft und die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten, sind laufend Neuentwicklungen und Verbesserungen an unseren bestehenden Produkten erforderlich (zum Beispiel, um den weiteren Verkleinerungen der Strukturen in der Halbleiterindustrie Rechnung zu tragen). Es besteht das Risiko, dass technische Neuentwicklungen von uns nicht rechtzeitig erkannt oder umgesetzt werden. In diesen Fällen sehen wir die Gefahr, dass SÜSS MicroTec seine Marktführerschaft in einzelnen Bereichen verlieren könnte und auf lange Sicht Umsatzeinbußen hinnehmen müsste.

Operative Risiken

Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Mit einem EBIT von 11,1 Mio. € hat der SÜSS MicroTec-Konzern 2016 zudem ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2016 vorhandenen Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2017 gehen wir davon aus, 2017 einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 160 Mio. € und 170 Mio. € und ein positives EBIT zwischen 9 Mio. € und 13 Mio. € zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2016 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,8 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie erwirtschaftet rund zwei Drittel des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und wird weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Die Produktlinie Mask-Aligner, die zum Segment Lithografie gehört, ist eine der umsatzstarken Produktlinien der SÜSS MicroTec-Gruppe und leistet seit vielen Jahren einen hohen Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Wir gehen fest davon aus, dass diese Produktlinie auch in den kommenden Jahren einen hohen Umsatzbeitrag und stabile Margen erzielen wird. Trotzdem besteht das Risiko, dass der Mask-Aligner zukünftig die technischen Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllen und von anderen Technologien verdrängt werden könnte. Dieses Risiko sehen wir jedoch als gering an. Zudem kann SÜSS MicroTec seinen Kunden

mit den in den USA angesiedelten Produktlinien, den Laser- und Scannersystemen, alternative Lösungen anbieten.

Auch die Produktlinie Belacker, die ebenfalls zum Segment Lithografie gehört, leistet seit vielen Jahren einen hohen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Seit Mitte 2013 haben wir zunehmend chinesische Wettbewerber wahrgenommen, die am Markt Kundenaufträge vor allem für technisch weniger anspruchsvolle Tools gewinnen konnten. Auch brachten japanische Hersteller, die teilweise bisher nur am Frontend-Markt tätig waren, verstärkt 300-mm-Systeme auf den Midend-/Backend-Markt und boten den Kunden technologisch gute Lösungen an. Wir haben in der Vergangenheit das Risiko gesehen, dass sowohl die japanischen als auch die chinesischen Hersteller auch die technologisch anspruchsvollen Geräte, an denen SÜSS MicroTec einen hohen Marktanteil hat, erfolgreich am Markt anbieten werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir jedoch gerade in China zahlreiche technologisch anspruchsvolle Belacker verkaufen und haben damit gute Margen erzielt. Das hat uns gezeigt, dass wir gegenüber unseren asiatischen Wettbewerbern technologisch immer noch eine führende Position einnehmen. Wir konnten uns bisher am Markt für Belacker gut behaupten und mussten keine Margeneinbußen hinnehmen. Das beschriebene Risiko sehen wir nun als deutlich geringer an.

Im Segment Lithografie sind auch die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems für UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung erfasst. Im Jahr 2015 konnten wir einen Großauftrag eines führenden Herstellers der Halbleiterindustrie über eine nennenswerte Stückzahl von Projektionsscannern des Typs DSC300 Gen2 verbuchen. Für alle im Rahmen dieses Großauftrags bestellten Projektionsscanner, die in der Serienfertigung im Fan-out-Wafer-Level-Packaging eingesetzt werden, haben wir in 2016 die Abnahme durch den Kunden erlangt. Seit September 2016 sind die Projektionsscanner in der Produktion des Kunden rund um die Uhr im Einsatz. Nach dieser erfolgreichen Produkt- und Technologiequalifizierung bei einem führenden Hersteller der Halbleiterindustrie hatten wir uns weitere Aufträge mit substanziellen Auftragsvolumina erhofft. Bisher konnten jedoch keine Aufträge von neuen Kunden für den UV-Projektionsscanner aus dem Bereich Photonic Systems gewonnen werden. Der Auftragseingang für die Produktlinie Laserprozessierung entwickelte sich ebenfalls sehr verhalten. Insgesamt haben die Produktlinien der SÜSS MicroTec Photonic Systems in 2016 ein deutlich negatives Ergebnis zum Konzernergebnis beigesteuert. Auch in 2017 werden die Photonic-Systems-Produktlinien ein negatives Ergebnis erzielen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der UV-Projektionsbelichtungssysteme weiter zu steigern, haben wir ein Entwicklungsprojekt ins Leben gerufen, das die technischen Fähigkeiten der DSC300 Gen2 weiter verbessern soll. Kernpunkte der Überarbeitung werden eine Verbesserung des Overlays speziell für Fan-out-Wafer-Level-Packaging-Anwendungen sowie ein deutlich höherer Durchsatz sein. Geplant ist, dieses Entwicklungsprojekt Ende 2017 abzuschließen und dann einen Projektionsscanner anbieten zu können, der bei den Kunden eine hohe Akzeptanz erreichen wird. Nach unserer Einschätzung kann ein positiver Ergebnisbeitrag mit den Photonic-Systems-Produktlinien nur erreicht werden, wenn das beschriebene Entwicklungsprojekt

zum gewünschten Ergebnis führt und es uns damit gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen. Sollte es SÜSS MicroTec nicht gelingen, mit den Laser- und Scannersystemen substanzielle Umsätze und positive Margen zu erzielen, würden dadurch das Ergebnis des Segments Lithografie und das Konzernergebnis sowie die Liquiditätslage weiterhin negativ beeinflusst werden.

Zudem könnte sich im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf auf die Ausleihungen an die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. sowie auf den Beteiligungsansatz der SÜSS MicroTec, Inc. – als finanzierende Gesellschaft der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. – ergeben, sofern die in den USA gefertigten Produktlinien dauerhaft ein negatives Ergebnis erzielen. Angesichts der enttäuschenden Entwicklung des Auftragseingangs in 2016 für Projektionsscanner und Laserprozessierung schätzen wir das beschriebene Risiko nun deutlich höher ein.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment Bonder zwar erneut defizitär und erzielte ein Segment-EBIT von -1,7 Mio. € (nach -4,0 Mio. € im Vorjahr). Wir gehen jedoch davon aus, dass das Segment Bonder mit Produktlinien im Bereich permanentes Bonden und temporäres Bonden im kommenden Jahr erstmals einen positiven Segment-EBIT erreichen wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir im Bereich des permanenten Bondens mit unserem neu entwickelten, halbautomatischen Wafer-Bonder XB8 erste Erfolge am Markt verzeichnen. Nach dem Markteintritt im dritten Quartal 2015 entwickelte sich die Nachfrage zunächst verhalten. In der zweiten Jahreshälfte 2016 konnten wir jedoch mehrere Auftragseingänge über eine größere Anzahl von Maschinen des Typs XB8 verzeichnen. Weitere Produktinnovationen sind geplant. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen und weiteren Maßnahmen verlorene Marktanteile im Markt für permanentes Bonden wieder zurückgewinnen und unsere Marktposition ausbauen können. Trotzdem besteht das Risiko, dass wir auf dem Markt für permanentes Bonden die erforderlichen Stückzahlen nicht werden erreichen können. In diesem Fall würden die permanenten Bonder auch in Zukunft einen negativen Ergebnisbeitrag zum Segmentergebnis liefern. Zudem könnten davon auch andere Produktlinien negativ beeinflusst werden. So erwarten vor allem Forschungsinstitute und Universitäten, aber auch Kunden im Bereich MEMS, dass sie Mask-Aligner, Belacker/Entwickler und Permanent Bonder von einem Anbieter beziehen können. Sollte es uns nicht gelingen, unsere permanenten Bondensysteme nachhaltig am Markt zu etablieren, wären auch bei den Produktlinien Belacker/Entwickler und Mask-Aligner Umsatzeinbußen denkbar.

Die Umsätze im Bereich temporäres Bonden haben sich in 2016 eher verhalten entwickelt. Wir konnten allerdings neue Aufträge und Kunden gewinnen und rechnen für 2017 mit höheren Umsätzen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden kontinuierliche Verbesserungen an den Produktionsplattformen XBS300 und XBC300 Gen2 vorgenommen. Dieses Entwicklungsprojekt wurde in Zusammenarbeit mit verschiedenen asiatischen und einem europäischen Produktionskunden sowie mit Kooperationspartnern

aus dem Forschungsumfeld durchgeführt. Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SÜSS MicroTec entwickelt und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary Bonding und Debonding hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt weiter durchsetzen und ob sich die 3D-Integration in der industriellen Fertigung für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den Verkauf hoher Stückzahlen werden wir zukünftig im Segment Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse erzielen können.

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert. Die Angemessenheit dieser Versicherungen, in deren Schutz auch die Konzerngesellschaften einbezogen sind, wird regelmäßig hinsichtlich der abgedeckten Risiken und Deckungssummen überprüft und bei Bedarf angepasst. Darüber hinaus bemühen wir uns, mit allen Vertragspartnern Haftungsbeschränkungen in den Verträgen zu vereinbaren.

Risiken der Informationstechnologie

Grundsätzlich sehen wir unsere IT-Infrastruktur als gut ausgebaut an und sind der Meinung, dass wir ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, um Datenmanipulationen, Datenverluste oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Zudem investieren wir regelmäßig in neue Hard- und Software, um den Ausfall von IT-Systemen und Softwarelösungen möglichst gering zu halten. Mit Virenskannern und Virenschutzprogrammen, die laufend auf dem aktuellen Stand gehalten werden, schützen wir unsere IT-Systeme vor Zugriffen und Beschädigungen von außen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu Datenmanipulationen, Datenverlusten oder Datenmissbrauch kommen könnte. Es ist auch denkbar, dass neue Viren oder Trojaner, die von unseren Sicherheitsprogrammen nicht erkannt werden, in unsere IT-Systeme eindringen könnten. Verschärft wird das Problem durch die zunehmende Nutzung von mobilen Endgeräten wie Notebooks oder Smartphones, die auf unser Firmennetzwerk zugreifen. Um das Risiko fremder Zugriffe auf unser Firmennetzwerk, das sich durch die Nutzung von mobilen Endgeräten ergibt,

möglichst gering zu halten, ist eine konzernweit geltende Richtlinie in Kraft, die den Umgang mit mobilen Endgeräten regelt.

FINANZIELLE RISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust von Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten Risk-Countries angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Zahlung des gesamten Auftragswerts, eine Bankgarantie oder einen Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten Non-Risk-Countries ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 24,5 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 20,5 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2016 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

ALTERSANALYSE DER ÜBERFÄLLIGEN FORDERUNGEN OHNE WERTBERICHTIGUNG

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|-------|-------|
| 1–30 Tage | 2.272 | 2.394 |
| 31–60 Tage | 447 | 1.040 |
| 61–90 Tage | 549 | 215 |
| 91–180 Tage | 10 | 0 |
| Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung | 3.278 | 3.649 |

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

ALTERSANALYSE DER ÜBERFÄLLIGEN FORDERUNGEN MIT WERTBERICHTIGUNGEN

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| < 91 Tage | 0 | 21 |
| 91–180 Tage | 228 | 527 |
| 181–360 Tage | 388 | 76 |
| > 360 Tage | 147 | 174 |
| Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung | 763 | 798 |

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net-Cash-Bestand von 31,1 Mio. € aus (Vorjahr: 40,0 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf -9,1 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €).

Zwischen der SÜSS MicroTec AG und der IKB Deutsche Industriebank AG besteht ein Darlehensvertrag, der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient. Das Darlehen belief sich ursprünglich auf 7,5 Mio. €. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht und weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Zum 31. Dezember 2016 weist der SÜSS MicroTec-Konzern für dieses Darlehen Bankverbindlichkeiten von 4,5 Mio. € aus. Die Tilgung für das Darlehen wird sich bis zum 30. Juni 2021 auf 1,0 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für das Darlehen bankübliche Zinsen an.

Dem SÜSS MicroTec-Konzern stehen insgesamt Kredit- und Avallinien von 5,25 Mio. € bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen zur Verfügung. Drei Banken stellen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Bankkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 0,75 Mio. € steht der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2016 sind diese Kredit- und Avallinien in Höhe von 2,8 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen. Wir gehen fest davon aus, dass wir auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 Prozent bzw. 45 Prozent. Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (29).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Ein Zinsänderungsrisiko für den SÜSS MicroTec Konzern ist nicht erkennbar. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

GESAMTEINSCHÄTZUNG

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2016 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

Die für den SÜSS MicroTec-Konzern wesentlichen Risiken sind in der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Die Risiken wurden dabei nach der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie nach den möglichen finanziellen Auswirkungen (gemessen an der Höhe des möglichen Liquiditätsabflusses) bewertet.

| | Eintrittswahrscheinlichkeit | | | | | Auswirkung | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | sehr gering | gering | mittel | hoch | sehr hoch | vertretbar | moderat | bedeutend | schwerwiegend | bestandsgefährdend |
| | > 0% bis ≤ 5% | > 5% bis ≤ 10% | > 10% bis ≤ 25% | > 25% bis ≤ 50% | > 50% bis ≤ 100% | 0 € bis ≤ 20 Tsd. € | > 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. € | > 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. € | > 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. € | > 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. € |
| Gesamtwirtschaftliche Risiken | | | | | | | | | | |
| Negative Auswirkungen durch Wechselkursschwankungen | | | x | | | | | x | | |
| Entwicklungsspezifische Risiken | | | | | | | | | | |
| Produktpolitik, Kundenzufriedenheit | | | x | | | | | | x | |
| Ungenügende Innovationsfähigkeit, verfehlte Entwicklungsprojekte | | | x | | | | | | x | |
| Verlust der Marktführerschaft in einzelnen Bereichen | | | x | | | | | | x | |
| Operative Risiken | | | | | | | | | | |
| Umsatzeinbußen bei Mask-Alignern | x | | | | | | | x | | |
| Verlust von Marktanteilen für Belacker ¹ | | | x | | | | | x | | |
| Keine Profitabilität von UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung ² | | | | x | | | | | x | |
| Permanentes Bonden – Marktanteil kann nicht ausgebaut werden | | | x | | | | | x | | |
| Temporäres Bonden – die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie setzt sich am Markt nicht durch | | | x | | | | | x | | |
| Produkthaftung | x | | | | | | | x | | |
| IT-Risiken | | | | | | | | | | |
| Datensicherheit | | | x | | | | x | | | |

¹ Eintrittswahrscheinlichkeit Vorjahr: hoch; Auswirkung im Vorjahr: schwerwiegend.

² Eintrittswahrscheinlichkeit Vorjahr: mittel; Auswirkung im Vorjahr: bedeutend.

Prognosebericht

Das Geschäftsumfeld von SÜSS MicroTec wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen sowie Branchenentwicklungen beeinflusst. In dem nachfolgenden Prognosebericht gehen wir auf die verschiedenen Faktoren ein, die das Unternehmen ebenso wie führende Markt- und Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Geschäftsentwicklung ansehen.

Gemäß den Schätzungen des ifo Instituts München haben sich die Konjunkturerwartungen zum Jahresende 2016 etwas aufgehellt. Der Indikator des ifo Index für die Weltwirtschaft lag im vierten Quartal 2016 bei 90,5 Punkten und damit deutlich über dem Wert des dritten Quartals von 86,0 Punkten. Trotz dieser Verbesserung lag der Dezemberwert damit rund sechs Indexpunkte unter seinem langfristigen Durchschnitt. Das Weltwirtschaftsklima verbesserte sich im vierten Quartal in nahezu allen Regionen, ausgenommen Mittel- und Osteuropa sowie Lateinamerika. In Nordamerika und Europa lag der Wert dagegen rund fünf Indexpunkte über seinem langfristigen Mittelwert. Für das Jahr 2017 erwartet das ifo Institut eine Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktion von 2,9 Prozent, nach voraussichtlich 2,4 Prozent im Jahr 2016. Für 2018 wird ein weiterer Zuwachs von weltweit 2,7 Prozent erwartet. Die Weltbank geht in ihren Schätzungen vom Januar 2017 von einem etwas geringeren Wachstum um 2,3 Prozent im Jahr 2016 und 2,7 Prozent im Jahr 2017 aus. Die politischen Ereignisse führen vielerorts zu einer erhöhten Unsicherheit, welche das Wachstum im Betrachtungszeitraum insgesamt etwas dämpfen dürfte.

Für die Eurozone prognostiziert die Weltbank eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,6 Prozent für 2016 sowie 1,5 Prozent im Jahr 2017. Ähnliche Werte werden gemäß der Herbstdiagnose der Europäischen Kommission auch für den gesamten Euroraum erwartet. Hauptwachstumstreiber dürften weiterhin der private Konsum sowie die günstigen Fremdfinanzierungskosten sein. Insgesamt sollten sich die Haushaltsdefizite in der Europäischen Union trotz wenig restriktiver Haushaltspolitik weiter abbauen. Auch hier gilt, dass sich die politische Ungewissheit negativ auf die Wachstumserwartungen auswirken könnte.

Im Geschäftsjahr 2016 stieg das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um voraussichtlich 1,9 Prozent. Für 2017 erwartet das ifo Institut einen verlangsamten Anstieg um 1,5 Prozent. Bereinigt man diese Erwartung allerdings um die im Vergleich zum Jahr 2016 geringere Zahl an Arbeitstagen, ergibt sich ein Wert von 1,8 Prozent. Der leichte Rückgang liegt im Wesentlichen an verringerten öffentlichen Ausgaben, insbesondere durch den rückläufigen migrationsgetriebenen öffentlichen Konsum. Der

private Konsum dagegen expandiert weiterhin kräftig, getragen durch höhere Tariflöhne und steigende Beschäftigungszahlen in Deutschland. Alles in allem dürfte 2017 gesamtwirtschaftlich ein weiteres Jahr mit moderatem Wirtschaftswachstum in einem unsicheren weltpolitischen Umfeld werden.

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

HALBLEITERINDUSTRIE

Im Geschäftsjahr 2016 erreichte der gesamte Halbleitermarkt gemäß aktuellen Schätzungen des Marktforschungsinstituts Gartner (Januar 2017) ein Volumen von 339,7 Mrd. USD. Dies entspricht einem leichten Zuwachs um 1,5 Prozent gegenüber den 334,8 Mrd. USD von 2015. Für das laufende Jahr 2017 prognostiziert Gartner einen sehr deutlichen Anstieg des Marktvolumens im Halbleiterbereich. Der Gesamtmarkt wird erwartungsgemäß um 7,2 Prozent von 339,7 Mrd. USD auf 364,1 Mrd. USD wachsen. Dies stellt eine Trendumkehr der vergangenen zwei Jahre dar und wird einen neuen Höchstwert in der Geschichte des Halbleitermarktes markieren. Erste Anzeichen hierfür wurden bereits im zweiten Halbjahr 2016 sichtbar, als der bis dahin stagnierende Markt zunehmend in Bewegung geriet. Bei den Halbleiterkunden zog die Nachfrage insgesamt an und die in der ersten Jahreshälfte 2016 leergebliebenen Lager wurden aufgefüllt, zudem stabilisierten sich die Preise, insbesondere für Speichermedien. Spannende Wachstumstreiber für 2017 dürften die Bereiche Automobilzulieferung, Industrieanwendungen sowie insgesamt der Markt für Speichermedien und Anwendungen rund um das „Internet der Dinge“ sein.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Der gesamte Halbleiter-Equipment-Markt zeigte sich in den vergangenen Jahren sehr volatil, positive Wachstumsraten von rund 9 Prozent im Jahr 2011 waren gefolgt von deutlichen Rückgängen um mehr als 10 Prozent in den Jahren 2012 und 2013. Für 2017 geht der Branchenverband SEMI von einem erneuten Zuwachs im Halbleiter-Equipment-Bereich von 39,69 Mrd. USD im Jahr 2016 auf 43,40 Mrd. USD im Jahr 2017 aus, dies entspricht einem deutlichen Plus von 9,3 Prozent. Die Gründe für das erwartete Wachstum liegen gemäß den Schätzungen von Gartner in der gesteigerten Nachfrage nach Speichermedien, wie beispielsweise NAND. Zudem hat sich der Markt für Smartphones besser entwickelt, als zunächst erwartet worden war. Dieser Trend begann bereits im zweiten Halbjahr 2016 und wird sich erwartungsgemäß 2017 unvermindert fortsetzen.

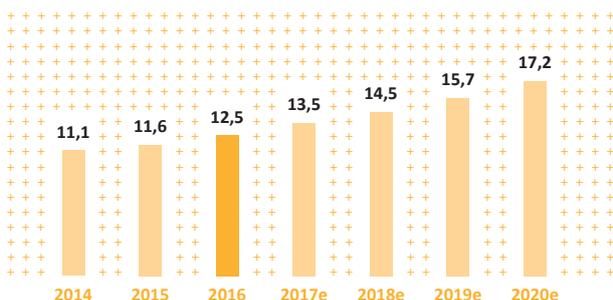
Für das Mid- und Backend der Halbleiterindustrie, den Hauptabsatzmarkt für SÜSS MicroTec-Maschinen, erwartet Gartner für 2017 in seinen Schätzungen vom 12. Januar 2017 einen nennenswerten Anstieg des Equipment-Marktvolumens im Bereich Wafer-Level-Packaging und -Assembly um rund 10,7 Prozent gegenüber 2016 (Vorjahr: plus 3,9 Prozent). Auch für diese Prognosen gilt die Aussage, dass die Erwartungen der Marktforschungsinstitute sich im Zeitablauf häufig deutlich verändern und gesicherte Prognosen nicht möglich sind.

ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMÄRKTEN

MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Der Markt für mikroelektromechanische Systeme (MEMS) entwickelte sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch. Die Nachfrage wurde im Wesentlichen durch steigende Smartphone-Verkäufe sowie eine erhöhte Anzahl von MEMS-Sensoren pro Smartphone getrieben. Der MEMS-Markt wird sich auch zukünftig gut entwickeln, aber die Wachstumsraten werden gemäß den Schätzungen von Yole Développement zunächst etwas geringer ausfallen. Ein Grund hierfür ist das zuletzt weniger dynamische Wachstum bei Smartphones und Tablet-PCs. Andere Anwendungen im Konsumgüterbereich sowie automobiler Anwendungen sind dagegen weiterhin stark nachgefragt. Zudem wirken sich steigende

MARKT FÜR MEMS in Mrd. USD



Quelle: Yole Développement, Mai 2016

Verkaufszahlen für tragbare Endgeräte wie Smartwatches oder Geräte zur Gesundheitsüberwachung positiv aus. Insgesamt sind die Verkaufszahlen in diesen Segmenten allerdings noch gering im Vergleich zu der Stückzahl verkaufter Smartphones. Auch Anwendungen im Rahmen des „Internets der Dinge“ sind heute noch vergleichsweise kleinvolumig, weisen aber enorme Wachstumszahlen auf. Yole Développement erwartet von 2015 bis 2021 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 13 Prozent für MEMS-Sensoren (Stückzahl). Dies entspricht knapp ca. 15,7 Mrd. USD im Jahr 2015 und rund 34,1 Mrd. USD im Jahr 2021. Für die Equipment-Branche ist zudem zu berücksichtigen, dass durch Effizienzgewinne, Durchsatz- und Yield-Erhöhungen sowie durch den Trend zu größeren Wafer-Durchmessern das Wachstum im Maschinenbereich erheblich geringer ausfallen wird.

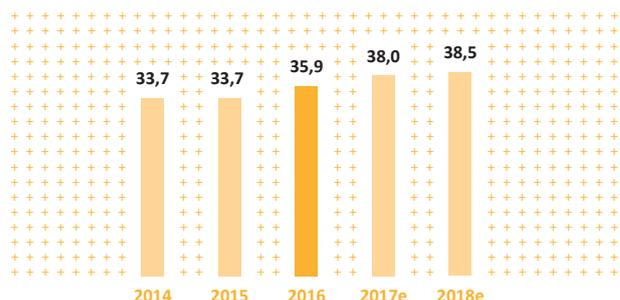
Ein besonderes Augenmerk sollte auf MEMS-Mikrofone, MEMS-Sensoren für Druck und Trägheit sowie für medizinische Anwendungen gerichtet werden. Hier erwarten die Experten von Yole Développement zukünftig vielversprechende Impulse für die Industrie. Ein weiterer spannender Bereich sind MEMS-Sensoren für Fingerabdrücke. In diesem, bisher noch kleinen, Segment erwarten die Marktforscher in den kommenden Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von bis zu 20 Prozent im Bereich Konsumelektronik.

ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Unter dem Begriff Advanced Packaging subsumiert man heute verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level-Packaging (WLP), bei dem die jeweilige Kontaktierung bereits stattfindet, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden. Dazu gibt es die Unterformen Fan-in- und Fan-out-WLP, Flip-Chip-Bonding, Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging sowie die 2,5D-Integration und die 3D-Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary-Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Gartner (Januar 2017) wuchs der Markt für Wafer-Level-Packaging- (WLP-) und -Assembly-Equipment im Jahr 2016 um 3,9 Prozent auf rund 1,8 Mrd. USD (Vorjahr: plus 4,4%). Im Geschäftsbericht 2015 wurde für das Jahr 2017 in diesem Segment ein kräftiges Wachstum um 14,6 Prozent prognostiziert. In seinen aktuellsten Schätzungen

MARKT FÜR WAFER-LEVEL-MANUFACTURING-EQUIPMENT in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 12. Januar 2017

zungen vom 12. Januar 2017 bestätigt Gartner grundsätzlich diese Aussage und erwartet nunmehr ein Wachstum in Höhe von 10,7 Prozent gegenüber 2016. Laut dem Marktforschungsinstitut Yole Développement werden insbesondere Maschinenbauer aus dem Bereich Lithografie von diesem Wachstum profitieren. SÜSS MicroTec konnte bereits 2015 mit seinen Lithografielösungen für moderne Fan-out-WLP-Anwendungen wichtige, großvolumige Aufträge verbuchen. Diese Aufträge wurden 2016 abgearbeitet und die Maschinen wurden ausgeliefert und installiert.

Die 3D-Integration ist die weiterentwickelte Form der heute eingesetzten Advanced-Packaging-Technologien. Hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinandergestapelt und durch TSVs (Thru-Silicon-Vias) miteinander verbunden. Die Vorteile sind eine große Packungsdichte und eine hohe Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D-Integration ist es zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen.

Bereits im Geschäftsjahr 2015 wurden nennenswerte Investitionen in diese Technologie getätigt, aber der Einstieg in die Großserienproduktion fand bei keinem Unternehmen statt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 setzte sich dieser Trend fort und SÜSS MicroTec konnte verschiedene Einzel- bzw. Folgeaufträge in diesem Bereich gewinnen. Der Einstieg in die Volumenproduktion lässt weiterhin auf sich warten, obwohl verschiedene große Halbleiterunternehmen verstärkte Aktivitäten in diesem Bereich aufweisen. Allerdings ist es aufgrund der bisherigen Verzögerung aus heutiger Sicht weiterhin sehr schwer, den zeitlichen Aspekt näher zu benennen. In der Zwischenzeit profitiert das Unternehmen von anderen neuartigen Packaging-Technologien, die bereits in nennenswertem Volumen zum Einsatz kommen und zudem großes Potenzial haben, wie beispielsweise 2,5D oder Fan-out-WLP oder Copper-Pillar Bumping.

SÜSS MicroTec ist zuversichtlich, dass die 3D-Technologie zukünftig zum Umsatz- und Ergebniswachstum des Unternehmens beitragen wird.

VERBINDUNGSHALBLEITER (LED)

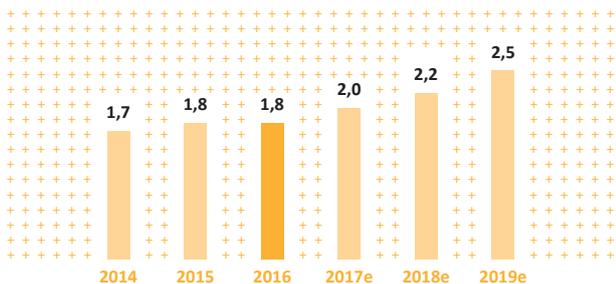
Der Markt für Verbindungshalbleiter spielt für SÜSS MicroTec eine eher untergeordnete Rolle. Nur die Jahre 2010 und 2011 stellten hierbei eine Ausnahme dar. 2016 lag der Anteil am Gesamtumsatz erneut deutlich unter 10 Prozent und aus heutiger Sicht ist kein nennenswerter Anstieg dieses Anteils abzusehen. Die Preise für LEDs haben sich über die letzten Jahre so stark verringert, dass zunehmend auch in privaten Haushalten LED-Lampen an Stelle von herkömmlichen Glühbirnen oder Energiesparlampen zu finden sind. Nachdem 2015 ein schwieriges Jahr für die LED-Industrie darstellte, hat sich der Markt 2016 wieder etwas erholt und die Stückzahlen für Packaged LEDs sind gestiegen. Lag der Umsatz 2015 noch bei 15 Mrd. USD, so prognostiziert Yole Développement (November 2016) für 2016 ein Marktvolumen von 15,7 Mrd. USD, für 2017 von 16,4 Mrd. USD und für 2018 ein deutlich gesteigertes Volumen von rund 17 Mrd. USD.

ENDOGENE INDIKATOREN

Neben der Entwicklung in den Zielmärkten ist für den Geschäftserfolg das Innovationspotenzial entscheidend. SÜSS MicroTec pflegte auch im Geschäftsjahr 2016 wichtige Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung. Kooperationen mit renommierten Universitäten und Forschungsinstituten sowie technologiegetriebenen Unternehmen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Darüber hinaus führte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr verschiedene Neuentwicklungen in den Markt ein.

In der ersten Jahreshälfte 2016 konnten wir mit der Markteinführung eines neuartigen UV-LED-Lampenhauses für den Einsatz in unseren Mask-Alignern eine umweltfreundliche Produktinnovation bekannt geben. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen bestrebt, ökonomisches Denken und Handeln mit nachhaltigen Aspekten in Einklang zu bringen. Mit der Entwicklung und Umsetzung des umweltfreundlichen UV-LED-Lampenhauskonzepts für Mask-Aligner ist SÜSS MicroTec ein weiterer wichtiger Schritt im Hinblick auf Ressourcenschonung und Umweltschutz gelungen.

MARKT FÜR WAFER-LEVEL-PACKAGING- UND -ASSEMBLY-EQUIPMENT
in Mrd. USD



Quelle: Gartner, 12. Januar 2017

Die Lebensdauer der innovativen UV-LED-Lichtquelle ist um ein Vielfaches höher als bei der bisher verwendeten Quecksilberdampfampe. Zusätzlich entfallen im Produktionsprozess die zeit- und energieintensiven Aufwärm- und Abkühlphasen – die LED muss nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Belichtung tatsächlich durchgeführt wird. Beide Faktoren tragen wesentlich zum geringeren Energieverbrauch bei. Schlussendlich ermöglicht der Einsatz von LED-Beleuchtung in der Lithografie eine deutlich flexiblere Prozessgestaltung und ist damit eine ideale Ergänzung zu SUSS Mask Aligner MO Exposure Optics, was optimale Belichtungsergebnisse sicherstellt.

Im Geschäftsjahr 2016 wurde zudem eine neue Generation des halbautomatischen Mask- und Bond-Aligners am Markt platziert. Diese zeichnet sich durch verbesserte Fähigkeiten im Hinblick auf Justagegenauigkeit, Ergonomie sowie geringere Betriebskosten aus. Mit der Markteinführung der vierten Generation setzt SÜSS MicroTec auf ein neuartiges Plattformsystem. Die beiden Plattformen unterscheiden sich durch ihre jeweilige Konfiguration und bestehen zum einen aus der MA/BA Gen4 für Standardprozesse, zum anderen aus der MA/BA-Gen4-Pro-Serie für anspruchsvolle High-End-Prozesse. Das Hauptanwendungsgebiet für SÜSS MicroTecs MA/BA-Gen4-Serie ist die Vollfeld-Lithografie für die Endmärkte MEMS, 3D Integration sowie den Markt für Verbindungshalbleiter und akademische Anwendungsbereiche. Die Geräteserie deckt Prozessschritte wie die Bond-Justage, das Fusionsbonden sowie SMILE-Imprint-Technologien ab. Neben der Bearbeitung von Standard-Wafern erlaubt die MA/BA-Gen4-Serie zudem die Handhabung von empfindlichen Substraten, beispielsweise von zerbrechlichen oder gebogenen Wafern oder Wafern mit einer unebenen Oberfläche.

Abschließend sei hier die Markteinführung einer neuen Generation der vollautomatischen ACS300-Plattform genannt. Die ACS300 Gen3 ist speziell für die Massenfertigung im Bereich Advanced Packaging, wie Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging, Fan-out-WLP, Copper-Pillar-Flip-Chip-Packaging und 3D-Packaging, konzipiert. Die Anlage erfüllt die hohen Anforderungen eines hart umkämpften und kostensensitiven Marktes. Ihre Fähigkeit, verschiedene Waferformen und -größen sowie unterschiedliche Lacke und Entwicklermaterialien zu bearbeiten, macht die Plattform zu einem effizienten Universalgerät. Zudem zeichnet sich die ACS300 Gen3 durch den sparsamen Umgang und Verbrauch von Chemikalien aus. Damit wird sowohl ökonomischen als auch ökologischen Belangen entsprochen, weshalb die Anlage selbst höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllt. Die ACS300 Gen3 ist das neue Flaggschiff für den Advanced-Packaging-Markt.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS – AUSBLICK 2017

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2016 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2017 prognostiziert das Unternehmen nun einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 160 Mio. € und 170 Mio. €. Dies ist eine leichte Erhöhung der Umsatzerwartung vom Juli 2016, die sich auf rund 160 Mio. € belief. Das EBIT für 2017 wird trotz des geringeren Umsatzes voraussichtlich erneut in einer Bandbreite von 9 Mio. € bis 13 Mio. € liegen. Der Hauptgrund hierfür ist die Erwartung einer gegenüber Vorjahr verbesserten Rohertragsmarge. In einem von kurzfristigen Kundenentscheidungen geprägten Marktumfeld gehen wir für das erste Quartal 2017 von einer moderaten Auftragseingangsentwicklung aus. Ab dem zweiten Quartal erwarten wir eine Belebung der Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen, werden jedoch im Gesamtjahr 2017 voraussichtlich einen Auftragseingang leicht unter dem Niveau des Vorjahres ausweisen. Für das Geschäftsjahr 2017 streben wir zudem einen positiven Free Cashflow an.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 wird ein Auftragseingang in Höhe von 25 Mio. € bis 35 Mio. € erwartet.

Das Segment Lithografie wird im Geschäftsjahr 2017 erneut den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Auf Basis des zum Jahresende 2016 gebuchten Auftragsbestands und der Auftragseingangserwartung für das erste Quartal 2017 rechnen wir gegenüber 2016 mit einem deutlich geringeren Umsatz und EBIT. Letzteres wird im Bereich 7 Mio. € bis 10 Mio. € erwartet. Für das Segment Bonder erwarten wir einen weiteren Umsatzanstieg und ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes, positives EBIT im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Auch für das Segment Fotomasken-Equipment erwarten wir einen Umsatzanstieg bei einer überproportionalen Verbesserung des EBIT. Letztere ist in einer deutlich verbesserten Bruttomarge begründet. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

ZUKUNFTSGERICHTETE ANGABEN

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 9. März 2017



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

Konzernabschluss nach IFRS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2016



| | |
|---|-----|
| Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS) | 104 |
| Gesamtergebnisrechnung (IFRS) | 105 |
| Konzernbilanz (IFRS) | 106 |
| Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) | 108 |
| Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS) | 110 |
| Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2016 | 112 |
| Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2015 | 114 |
| Segmentberichterstattung (IFRS) | 116 |
| Anhang zum IFRS-Konzernabschluss | 118 |
| Erläuterungen zur IFRS-Konzern- Gewinn- und -Verlustrechnung | 127 |
| Erläuterungen zu den Aktiva | 131 |
| Erläuterungen zu den Passiva | 133 |
| Sonstige Angaben | 140 |
| Versicherung der gesetzlichen Vertreter | 148 |
| Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers | 149 |

Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung (IFRS)

| <i>in Tsd. €</i> | Anhang | 01.01.2016–31.12.2016 | 01.01.2015–31.12.2015 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Umsatzerlöse | (3) | 177.582 | 148.516 |
| Umsatzkosten | (4) | -118.955 | -99.154 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | | 58.627 | 49.362 |
| Vertriebskosten | | -20.521 | -18.811 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | | -14.137 | -12.787 |
| Verwaltungskosten | | -13.601 | -13.286 |
| Sonstige betriebliche Erträge | (5) | 4.268 | 4.869 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (6) | -3.488 | -4.374 |
| Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT): | | | |
| EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization) | | 15.298 | 9.156 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen | (10) | -4.150 | -4.183 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | | 11.148 | 4.973 |
| Finanzerträge | | 91 | 258 |
| Finanzaufwendungen | | -720 | -526 |
| Finanzergebnis | (7) | -629 | -268 |
| Gewinn vor Steuern | | 10.519 | 4.705 |
| Ertragsteuern | (8) | -5.517 | -4.480 |
| Gewinn | | 5.002 | 225 |
| davon SÜSS MicroTec-Aktionäre | | 5.002 | 225 |
| davon nicht beherrschende Anteile | | 0 | 0 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | (9) | | |
| Ergebnis je Aktie in € | | 0,26 | 0,01 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | (9) | | |
| Ergebnis je Aktie in € | | 0,26 | 0,01 |

Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

| <i>in Tsd. €</i> | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Periodenergebnis | 5.002 | 225 |
| Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | | |
| Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne | -168 | -532 |
| Latente Steuern | 69 | 165 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | -99 | -367 |
| Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | | |
| Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere | 0 | -11 |
| Fremdwährungsanpassung | 415 | 2.765 |
| Absicherung künftiger Zahlungsströme | 410 | 76 |
| Latente Steuern | -115 | -18 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | 710 | 2.812 |
| Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen | 611 | 2.445 |
| Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen | 5.613 | 2.670 |
| davon SÜSS MicroTec-Aktionäre | 5.613 | 2.670 |
| davon nicht beherrschende Anteile | 0 | 0 |

Konzernbilanz (IFRS)

| <i>in Tsd. €</i> | Anhang | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva | | | |
| Langfristige Vermögenswerte | | 42.782 | 43.402 |
| Immaterielle Vermögenswerte | (11) | 3.522 | 4.266 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | (12) | 15.840 | 15.772 |
| Sachanlagen | (13) | 20.563 | 20.263 |
| Steuererstattungsansprüche | (18) | 0 | 37 |
| Sonstige Vermögenswerte | (14) | 652 | 611 |
| Latente Steueransprüche | (8) | 2.205 | 2.453 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | | 136.844 | 133.804 |
| Vorräte | (15) | 73.804 | 68.719 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (16) | 24.111 | 13.093 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | (17) | 159 | 221 |
| Steuererstattungsansprüche | (18) | 375 | 414 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (19) | 35.621 | 49.085 |
| Sonstige Vermögenswerte | (20) | 2.774 | 2.272 |
| Bilanzsumme | | 179.626 | 177.206 |

| <i>in Tsd. €</i> | Anhang | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|---------------|-------------------|-------------------|
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | | 124.353 | 118.740 |
| Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG | | 124.353 | 118.740 |
| Gezeichnetes Kapital | (21) | 19.116 | 19.116 |
| Rücklagen | (21) | 103.811 | 98.809 |
| Kumuliertes übriges Eigenkapital | (21) | 1.426 | 815 |
| Langfristige Schulden | | 8.337 | 13.108 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (22) | 4.837 | 5.144 |
| Rückstellungen | (23) | 0 | 11 |
| Finanzschulden | (24) | 3.500 | 7.920 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | | 0 | 33 |
| Kurzfristige Schulden | | 46.936 | 45.358 |
| Rückstellungen | (25) | 5.161 | 2.362 |
| Steuerschulden | (28) | 3.821 | 3.327 |
| Finanzschulden | (24) | 1.007 | 1.186 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | (26) | 5.359 | 6.545 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 3.362 | 8.472 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | (27) | 28.226 | 23.466 |
| Bilanzsumme | | 179.626 | 177.206 |

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)

| <i>in Tsd. €</i> | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Gewinn (nach Steuern) | 5.002 | 225 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 1.290 | 1.239 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.860 | 2.944 |
| Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 52 | 42 |
| Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen | 1.580 | -407 |
| Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -75 | 149 |
| Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | -46 | -93 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen | 619 | -1.370 |
| Veränderung des Vorratsvermögens | -6.071 | -7.675 |
| Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -10.673 | 1.289 |
| Veränderung der übrigen Vermögenswerte | -481 | -624 |
| Veränderung der Pensionsrückstellungen | -374 | 393 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -5.516 | 4.670 |
| Veränderung der erhaltenen Anzahlungen | 4.381 | -88 |
| Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 1.184 | 383 |
| Veränderung der Steuerforderungen und Steuerverbindlichkeiten | 818 | 3.593 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -5.450 | 4.670 |

| <i>in Tsd. €</i> | 01.01.2016 – 31.12.2016 | 01.01.2015 – 31.12.2015 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen | -3.149 | -2.609 |
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -493 | -803 |
| Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | 0 | 1.000 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -3.642 | -2.412 |
| Tilgung von Bankdarlehen | -4.600 | -1.180 |
| Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten | 1 | -1 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -4.599 | -1.181 |
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 227 | 699 |
| Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -13.464 | 1.776 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang | 49.085 | 47.309 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode | 35.621 | 49.085 |
| Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält | | |
| Zinszahlungen während der Periode | 667 | 406 |
| Zinseinnahmen während der Periode | 84 | 272 |
| Steuerzahlungen während der Periode | 4.724 | 865 |
| Steuererstattungen während der Periode | 1 | 129 |

Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)

| <i>in Tsd. €</i> | Gezeichnetes Kapital | Kapital- rücklage | Gewinnrücklage | Bilanzgewinn/ -verlust |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Stand 01.01.2015 | 19.116 | 97.614 | 433 | 537 |
| Periodenergebnis | | | | 225 |
| Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen | | | | 225 |
| Gesamtergebnis | | | | 225 |
| Stand 31.12.2015 | 19.116 | 97.614 | 433 | 762 |
| Stand 01.01.2016 | 19.116 | 97.614 | 433 | 762 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage der SÜSS MicroTec AG | | -26.067 | | 26.067 |
| Periodenergebnis | | | | 5.002 |
| Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen | | | | 5.002 |
| Gesamtergebnis | | | | 5.002 |
| Stand 31.12.2016 | 19.116 | 71.547 | 433 | 31.831 |

| Kumuliertes übriges Eigenkapital | | | | | | | Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital |
|---|-----------------|--------------------------|--|---|-----------------|----------------|---|-----------------------------|--------------|
| Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | | | Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden | | | | | | |
| Neubewertung von leistungsorientierten Plänen | Latente Steuern | Fremdwährungsanpassungen | Absicherung künftiger Zahlungsströme | Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere | Latente Steuern | | | | |
| -2.313 | 532 | 493 | -486 | 11 | 133 | 116.070 | 0 | 116.070 | |
| | | | | | | 225 | | 225 | |
| -532 | 165 | 2.765 | 76 | -11 | -18 | 2.445 | | 2.445 | |
| -532 | 165 | 2.765 | 76 | -11 | -18 | 2.670 | | 2.670 | |
| -2.845 | 697 | 3.258 | -410 | 0 | 115 | 118.740 | 0 | 118.740 | |
| -2.845 | 697 | 3.258 | -410 | 0 | 115 | 118.740 | 0 | 118.740 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 5.002 | | 5.002 | |
| -168 | 69 | 415 | 410 | 0 | -115 | 611 | | 611 | |
| -168 | 69 | 415 | 410 | 0 | -115 | 5.613 | | 5.613 | |
| -3.013 | 766 | 3.673 | 0 | 0 | 0 | 124.353 | 0 | 124.353 | |

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Der Anlagenspiegel ist Teil des Konzernanhangs.

ANLAGESPIEGEL 2016

| in Tsd. € | Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| | 01.01.2016 | Währungs- differenz | Zugang aus Investitionen | Umbuchungen/ Umgliederungen | Abgang |
| I. Immaterielle Vermögenswerte | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 18.231 | 62 | 493 | | 114 |
| 2. Entwicklungskosten | 29.493 | 27 | | | |
| 3. Software | 183 | 11 | | | 196 |
| 4. Andere immaterielle Vermögenswerte | 3.334 | 74 | | | 71 |
| | 51.241 | 174 | 493 | 0 | 381 |
| II. Geschäfts- oder Firmenwert | 30.185 | 68 | | | |
| III. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten | 16.613 | 25 | 538 | | 342 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 11.350 | 114 | 1.286 | 798 | 549 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.765 | 32 | 945 | | 767 |
| 4. Fahrzeuge | 374 | -2 | | | 15 |
| 5. Anlagen im Bau | 432 | 14 | 374 | -798 | |
| 6. Aktivierte Leasinggegenstände | | | | | |
| Grundstücke, Gebäude, Einbauten | 0 | 0 | | | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 669 | 29 | | | 266 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21 | 2 | 7 | | 31 |
| Fuhrpark | 30 | 2 | | | |
| | 40.254 | 216 | 3.150 | 0 | 1.970 |
| IV. Finanzanlagen | | | | | |
| Sonstige Finanzanlagen | 2.120 | | | | |
| | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kumulierte Abschreibungen | | | | | | | Restbuchwerte | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 31.12.2016 | 01.01.2016 | Währungs- differenz | Zugang | Umbuchungen/ Umgliederungen | Abgang | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | |
| 18.672 | 15.442 | 47 | 919 | | 114 | 16.294 | 2.789 | 2.378 | |
| 29.520 | 29.241 | 27 | 74 | | | 29.342 | 252 | 178 | |
| -2 | 183 | 11 | | | 196 | -2 | 0 | 0 | |
| 3.337 | 2.109 | 36 | 297 | | 71 | 2.371 | 1.225 | 966 | |
| 51.527 | 46.975 | 121 | 1.290 | 0 | 381 | 48.005 | 4.266 | 3.522 | |
| 30.253 | 14.413 | | | | | 14.413 | 15.772 | 15.840 | |
| 16.834 | 2.440 | 20 | 516 | | 342 | 2.634 | 14.173 | 14.200 | |
| 12.999 | 7.784 | 77 | 1.410 | | 540 | 8.731 | 3.566 | 4.268 | |
| 10.975 | 8.705 | 26 | 915 | | 735 | 8.911 | 2.060 | 2.064 | |
| 357 | 342 | -2 | 12 | | 4 | 348 | 32 | 9 | |
| 22 | 0 | | | | | 0 | 432 | 22 | |
| 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 432 | 669 | 29 | | | 266 | 432 | 0 | 0 | |
| -1 | 21 | 2 | 7 | | 31 | -1 | 0 | 0 | |
| 32 | 30 | 2 | | | | 32 | 0 | 0 | |
| 41.650 | 19.991 | 154 | 2.860 | 0 | 1.918 | 21.087 | 20.263 | 20.563 | |
| 2.120 | 2.120 | | | | | 2.120 | 0 | 0 | |
| 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120 | 0 | 0 | |

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Der Anlagenspiegel ist Teil des Konzernanhangs.

ANLAGESPIEGEL 2015

| in Tsd. € | Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| | 01.01.2015 | Währungs- differenz | Zugang aus Investitionen | Umbuchungen/ Umgliederungen | Abgang |
| I. Immaterielle Vermögenswerte | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 17.224 | 207 | 802 | | 2 |
| 2. Entwicklungskosten | 29.401 | 91 | 1 | | |
| 3. Software | 165 | 18 | | | |
| 4. Andere immaterielle Vermögenswerte | 3.089 | 245 | | | |
| | 49.879 | 561 | 803 | 0 | 2 |
| II. Geschäfts- oder Firmenwert | 29.959 | 226 | | | |
| III. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten | 16.922 | 140 | 510 | | 959 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.645 | 904 | 825 | | 24 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.413 | 146 | 834 | | 628 |
| 4. Fahrzeuge | 421 | 6 | 10 | | 63 |
| 5. Anlagen im Bau | 2 | | 430 | | |
| 6. Aktivierte Leasinggegenstände | | | | | |
| Grundstücke, Gebäude, Einbauten | 0 | | | | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 601 | 68 | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18 | 3 | | | |
| Fuhrpark | 26 | 4 | | | |
| | 38.048 | 1.271 | 2.609 | 0 | 1.674 |
| IV. Finanzanlagen | | | | | |
| Sonstige Finanzanlagen | 2.120 | | | | |
| | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kumulierte Abschreibungen | | | | | | Restbuchwerte | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 31.12.2015 | 01.01.2015 | Währungs- differenz | Zugang | Umbuchungen/ Umgliederungen | Abgang | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| 18.231 | 14.492 | 133 | 819 | | 2 | 15.442 | 2.732 | 2.789 |
| 29.493 | 29.019 | 90 | 132 | | | 29.241 | 382 | 252 |
| 183 | 165 | 18 | | | | 183 | 0 | 0 |
| 3.334 | 1.732 | 89 | 288 | | | 2.109 | 1.357 | 1.225 |
| 51.241 | 45.408 | 330 | 1.239 | 0 | 2 | 46.975 | 4.471 | 4.266 |
| 30.185 | 14.413 | | | | | 14.413 | 15.546 | 15.772 |
| 16.613 | 2.537 | 99 | 763 | | 959 | 2.440 | 14.385 | 14.173 |
| 11.350 | 5.964 | 551 | 1.270 | | 1 | 7.784 | 3.681 | 3.566 |
| 10.765 | 8.332 | 103 | 887 | | 617 | 8.705 | 2.081 | 2.060 |
| 374 | 377 | 3 | 17 | | 55 | 342 | 44 | 32 |
| 432 | 0 | | | | | 0 | 2 | 432 |
| 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 601 | 68 | | | | 669 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | 3 | | | | 21 | 0 | 0 |
| 30 | 21 | 2 | 7 | | | 30 | 0 | 0 |
| 40.254 | 17.850 | 829 | 2.944 | 0 | 1.632 | 19.991 | 20.198 | 20.263 |
| 2.120 | 2.120 | | | | | 2.120 | 0 | 0 |
| 2.120 | 2.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120 | 0 | 0 |

Segmentberichterstattung (IFRS)

Die Segmentberichterstattung ist Teil des Konzernanhangs.

SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSFELDERN

| in Tsd. € | Lithografie | | Bonder | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Außenumsatz | 133.771 | 106.299 | 13.983 | 11.389 |
| Innenumsatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamter Umsatz | 133.771 | 106.299 | 13.983 | 11.389 |
| Segmentergebnis (EBIT) | 13.170 | 9.683 | -1.697 | -3.956 |
| Ergebnis vor Steuern | 13.144 | 9.662 | -1.701 | -3.958 |
| Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-)/Erträge | -1.871 | 125 | 314 | 521 |
| Segmentvermögen | 83.311 | 80.711 | 12.364 | 9.414 |
| davon Geschäfts- oder Firmenwert | 15.840 | 15.772 | 0 | 0 |
| Nicht zugeordnetes Konzernvermögen | | | | |
| Konzernaktiva | | | | |
| Segmentsschulden | -23.969 | -29.386 | -7.301 | -3.729 |
| Nicht zugeordnete Konzernschulden | | | | |
| Konzernschulden | | | | |
| Abschreibungen | 1.759 | 1.808 | 260 | 300 |
| davon planmäßig | 1.759 | 1.808 | 260 | 300 |
| davon außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 1.446 | 1.464 | 159 | 121 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | 452 | 439 | 86 | 95 |

SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN

| in Tsd. € | Umsatzerlöse | | Investitionen | | Vermögen (ohne Goodwill) | |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| EMEA | 43.131 | 40.538 | 2.914 | 2.583 | 90.065 | 78.339 |
| Nordamerika | 25.402 | 27.962 | 594 | 760 | 27.523 | 22.182 |
| Asien und Pazifik | 109.049 | 80.016 | 134 | 69 | 6.466 | 6.102 |
| Konsolidierungseffekte | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.054 | -281 |
| Gesamt | 177.582 | 148.516 | 3.642 | 3.412 | 122.000 | 106.342 |

| Fotomasken-Equipment | | Sonstige | | Konsolidierungseffekte | | Summe | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| 19.693 | 23.498 | 10.135 | 7.330 | – | – | 177.582 | 148.516 |
| 0 | 0 | 7.025 | 6.251 | -7.025 | -6.251 | 0 | 0 |
| 19.693 | 23.498 | 17.160 | 13.581 | -7.025 | -6.251 | 177.582 | 148.516 |
| 1.818 | 2.319 | -2.143 | -3.073 | – | – | 11.148 | 4.973 |
| 1.814 | 2.314 | -2.738 | -3.313 | – | – | 10.519 | 4.705 |
| 443 | -42 | -1.089 | -224 | – | – | -2.203 | 380 |
| 19.088 | 9.420 | 23.077 | 22.569 | – | – | 137.840 | 122.114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15.840 | 15.772 |
| | | | | | | 41.786 | 55.092 |
| | | | | | | 179.626 | 177.206 |
| -4.320 | -2.576 | -2.175 | -2.645 | – | – | -37.765 | -38.336 |
| | | | | | | -17.508 | -20.130 |
| | | | | | | -55.273 | -58.466 |
| 136 | 207 | 1.995 | 1.868 | – | – | 4.150 | 4.183 |
| 136 | 207 | 1.995 | 1.868 | – | – | 4.150 | 4.183 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 89 | 93 | 1.948 | 1.734 | – | – | 3.642 | 3.412 |
| 103 | 103 | 70 | 61 | – | – | 711 | 698 |

Anhang zum IFRS-Konzernabschluss

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2016

(1) BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden einen international tätigen Konzern, der Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Corona in den USA und Hauterive (Kanton Neuchâtel) in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC) aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Der Konzernabschluss wurde grundsätzlich auf Basis historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten erstellt. Historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten basieren im Allgemeinen auf dem beizulegenden Zeitwert der im Austausch für den Vermögenswert entrichteten Gegenleistung. Davon ausgenommen sind bestimmte Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert am Bilanzstichtag angesetzt wurden. Eine entsprechende Erläuterung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2016 werden beim Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Im Geschäftsjahr 2016 hat die SÜSS MicroTec AG die nachfolgenden Änderungen zu bestehenden Standards erstmalig angewendet:

- Änderungen zum IFRS 11 „Joint Arrangements“ (vom IASB am 6. Mai 2014 veröffentlicht)
- Änderungen zum IAS 16 „Property, Plant and Equipment“ und zum IAS 38 „Intangible Assets“ (vom IASB am 12. Mai 2014 veröffentlicht)
- Änderungen zum IAS 1 „Disclosure Initiative“ (vom IASB am 18. Dezember 2014 veröffentlicht)
- Änderungen zum IAS 19 „Employee Benefits“ (vom IASB am 21. November 2013 veröffentlicht)

Aus der erstmaligen Anwendung der geänderten Standards haben sich keine Auswirkungen auf die Darstellung des Abschlusses der SÜSS MicroTec AG ergeben.

Die SÜSS MicroTec AG hat außerdem die Änderungen von Standards, die sich aus den jährlichen Verbesserungen der IFRS des Zyklus 2012 bis 2014 sowie des Zyklus 2010 bis 2012 ergeben haben, im Geschäftsjahr 2016 berücksichtigt. Aus der erstmaligen Anwendung haben sich keine Auswirkungen auf die Darstellung des Abschlusses ergeben.

C) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen von Standards bzw. Interpretationen herausgegeben, deren Anwendung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verpflichtend ist:

IFRS 9 „Financial Instruments“

IFRS 9 „Financial Instruments“ wurde vom IASB erstmals in November 2009 bekannt gemacht. Die finale Fassung wurde im Juli 2014 veröffentlicht und im November 2016 in EU-Recht übernommen. IFRS 9 enthält Vorschriften für den Ansatz, die Bewertung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten sowie für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Die bisher unter IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ vorgenommene Bilanzierung von Finanzinstrumenten kann nun vollständig durch die Bilanzierung unter IFRS 9 ersetzt werden.

Die zentralen Anforderungen des finalen IFRS 9 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Regelungen von IFRS 9 sehen im Vergleich zu IAS 39 ein neues Klassifizierungsmodell für finanzielle Vermögenswerte vor. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte richtet sich künftig nach drei Kategorien mit unterschiedlichen Wertmaßstäben und einer unterschiedlichen Erfassung von Wertänderungen.
- Für finanzielle Schulden wurden die bestehenden Vorschriften des IAS 39 weitgehend unverändert in IFRS 9 übernommen. Die einzig wesentliche Neuerung betrifft finanzielle Verbindlichkeiten in der Fair-Value-Option.
- IFRS 9 sieht drei Stufen vor, welche die Höhe der zu erfassenden Verluste und die Zinsvereinnahmung künftig bestimmen.
- Neben umfangreichen Übergangsvorschriften ist IFRS 9 auch mit umfangreichen Offenlegungsvorschriften sowohl beim Übergang als auch in der laufenden Anwendung verbunden.

IFRS 9 ist für alle Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Die Erstanwendung hat grundsätzlich retrospektiv zu erfolgen, jedoch werden diverse Vereinfachungsoptionen gewährt. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

SÜSS MicroTec wird IFRS 9 erstmalig zum 1. Januar 2018 anwenden. Die tatsächlichen Auswirkungen der Anwendung des IFRS 9 auf den Konzernabschluss im Jahr 2018 können nicht verlässlich geschätzt werden, da sie von den Finanzinstrumenten, die der Konzern hält, und den wirtschaftlichen Bedingungen zu diesem Zeitpunkt abhängen sowie von der Wahl der Rechnungslegungsmethoden und von Ermessensentscheidungen, die künftig vom Konzern getroffen werden. Auf Basis der derzeit ausgewiesenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Schulden geht SÜSS MicroTec jedoch davon aus, dass das neue Klassifizierungsmodell und die neuen Bewertungsmethoden des IFRS 9 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns bei Erstanwendung des neuen Standards haben werden.

IFRS 15: „Revenue from Contracts with Customers“

Der neue IFRS 15 „Revenue from Contracts with Customers“ wurde vom IASB im Mai 2014 veröffentlicht und schreibt vor, wann und in welcher Höhe Erlöse zu erfassen sind. Zielsetzung des neuen Standards zur Umsatzrealisierung ist es, die Vielzahl der bisher in diversen Standards und Interpretationen enthaltenen Regelungen zusammenzuführen. Gleichzeitig werden einheitliche Grundprinzipien festgelegt, die für alle Branchen und für alle Arten von Umsatztransaktionen anwendbar sind. Die Fragen, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt bzw. über welchen Zeitraum Umsatz zu realisieren ist, sind mit Hilfe eines prinzipienbasierten fünfstufigen Modells zu beantworten. Daneben enthält IFRS 15 eine Reihe von weiteren Regelungen zu Detailfragestellungen sowie eine Ausweitung der erforderlichen Anhangsangaben.

Am 11. September 2015 veröffentlichte das IASB eine Änderung des IFRS 15, mit der sich der Erstanwendungszeitpunkt um ein Jahr auf den 1. Januar 2018 verschiebt. Damit sind die neuen Regelungen zur Umsatzlegung nun für Geschäftsjahre anzuwenden,

die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. Der neue Standard wurde im Oktober 2016 in europäisches Recht übernommen.

SÜSS MicroTec hat in 2016 ein Projekt zur konzernweiten Einführung von IFRS 15 aufgesetzt. Das Projekt umfasst eine detaillierte Analyse, inwieweit die einzelnen Vertragskonstellationen, die SÜSS MicroTec mit Kunden üblicherweise abschließt, von den Neuregelungen des IFRS 15 betroffen sind. Im Rahmen eines zentralen Workshops mit Teilnehmern aus Accounting, Controlling, Legal, Sales und IT wurden im Herbst 2016 alle potenziellen Auswirkungen des IFRS 15 diskutiert und die entsprechenden Einschätzungen dokumentiert. Für SÜSS MicroTec relevante Themen mit möglichem Anpassungsbedarf wurden identifiziert und zu einer Shortlist konsolidiert.

Auf Grundlage der durchgeführten Detailanalyse wurden – verglichen mit der bisherigen Umsatzerfassung – folgende Erkenntnisse gewonnen:

- Basierend auf der durchgeführten Analyse geht SÜSS MicroTec davon aus, dass im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Maschine die Kombination aus Produktion, Lieferung und Installation der Maschine sowie die Initialschulung des Kunden und die gesetzliche Gewährleistung insgesamt eine unterscheidbare Leistungsverpflichtung im Sinne des IFRS 15 darstellt.
- Es ist zu erwarten, dass Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen, die derzeit mit Endabnahme durch den Kunden realisiert werden, auch weiterhin zeitpunktbezogen zu realisieren sind. Der Zeitpunkt der Endabnahme durch den Kunden stellt den Zeitpunkt des Kontrollübergangs auf den Kunden dar. Bei der ganz überwiegenden Anzahl der produzierten Maschinen geht SÜSS MicroTec von einem alternativen Nutzen aus.
- Bei Kundenverträgen, die mehrere separierbare Leistungsverpflichtungen umfassen, ist gemäß IFRS 15 der gesamte Transaktionspreis anhand der Relation der Einzelveräußerungspreise auf die einzelnen Leistungsverpflichtungen zu allokieren. Dadurch wird die zeitliche Verteilung der Umsatzerfassung beeinflusst. Bei SÜSS MicroTec beinhalten zahlreiche Kundenverträge mehrere Leistungsverpflichtungen, die jeweils unterschiedlich rabattiert sein können.
- Sollten Vertragskombinationen vorliegen, muss gemäß IFRS 15 eine Reallokation der Transaktionspreise zwischen einzelnen Verträgen vorgenommen werden. Dadurch wird die zeitliche Verteilung der Umsatzerfassung beeinflusst. SÜSS MicroTec geht jedoch davon aus, dass Vertragskombinationen nur sehr vereinzelt auftreten werden.
- Daneben geht SÜSS MicroTec von Änderungen in der Bilanz (zum Beispiel durch separate Posten für Contract-Assets und Contract-Liabilities) und zusätzlichen quantitativen und qualitativen Anhangsangaben aus.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Umstellung auf IFRS 15 bei SÜSS MicroTec keine gravierenden Änderungen in Art und Zeitpunkt der Umsatzrealisierung zu erwarten sind. Aus der Reallokation von Transaktionspreisen auf mehrere Leistungsverpflichtungen bzw. mehrere Kundenverträge werden sich jedoch zeitliche Unterschiede in der Realisation von Teilen der Umsatzerlöse ergeben. Insgesamt geht die SÜSS MicroTec AG nicht davon aus, dass sich aus der Umstellung auf IFRS 15 wesentliche materielle Auswirkungen ergeben werden.

IFRIC 22 „Foreign Currency Transactions and Advance Consideration“

Am 8. Dezember 2016 hat das IASB IFRIC 22 veröffentlicht. Damit wird klargestellt, auf welchen Zeitpunkt der Wechselkurs für die Umrechnung von Transaktionen in Fremdwährung zu ermitteln ist, die erhaltene oder geleistete Anzahlungen beinhalten. IFRIC 22 ist ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden; eine frühere Anwendung ist zulässig. SÜSS MicroTec erwartet aus der erstmaligen Anwendung von IFRIC 22 keine Auswirkungen.

IAS 7 „Statement of Cash Flows“

Am 29. Januar 2016 hat das IASB Änderungen an IAS 7 „Statements of Cash Flows“ veröffentlicht, die zum Ziel haben, die Informationen über die Veränderung der Verschuldung des Unternehmens zu verbessern. Der geänderte Standard ist ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden, sofern die Änderungen in europäisches Recht übernommen werden. Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung des geänderten Standards keine wesentlichen Auswirkungen.

IAS 12 „Income Taxes“

Im Januar 2016 hat das IASB Änderungen an IAS 12 veröffentlicht, die den Ansatz von aktiven latenten Steuern bei nicht realisierten Verlusten zum Thema haben. Die Änderungen sind ab dem 1. Januar 2017 anzuwenden, sofern die Änderungen in europäisches Recht übernommen werden. Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung des geänderten Standards keine Auswirkungen.

IFRS 16 „Leases“

Am 13. Januar 2016 hat das IASB IFRS 16 „Leases“ veröffentlicht. Kerngedanke des neuen Standards ist es, beim Leasingnehmer generell alle Leasingverhältnisse und die damit verbundenen vertraglichen Rechte und Verpflichtungen in der Bilanz zu erfassen. Die bisher unter IAS 17 erforderliche Unterscheidung zwischen Finanzierungs- und Operating-Leasingverträgen entfällt damit künftig für den Leasingnehmer. Die neuen Regelungen sind verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Der Standard wurde noch nicht in EU-Recht übernommen.

SÜSS MicroTec hat mit einer ersten Beurteilung der möglichen Auswirkungen auf seinen Konzernabschluss begonnen. Bislang wurde als wesentlichste Auswirkung identifiziert, dass der Konzern neue Vermögenswerte und Schulden für sämtliche gemieteten Räume und Flächen erfassen wird. Auch für die geleasteten Firmenfahrzeuge werden neue Vermögenswerte und Schulden in der Bilanz zu erfassen sein. Die Gebäude in Garching und Sternenfels, an denen die SÜSS MicroTec AG, die SÜSS MicroTec Lithography GmbH und die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben, stehen im Eigentum der SÜSS MicroTec AG und sind somit von den Neuregelungen des IFRS 16 nicht betroffen. Die Art der Aufwendungen, die mit den Miet- und Leasingverhältnissen verbunden sind, wird sich insofern

ändern, als die linearen Aufwendungen für die Operating-Leasingverhältnisse durch einen Abschreibungsaufwand für Nutzungsrechte (Right-of-Use-assets) und Zinsaufwendungen für Schulden aus dem Leasingverhältnis ersetzt werden.

D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des True and Fair View sowie der Fair Presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber Vorjahr angewendet.

Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS MicroTec-Konzern den operativen Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf der Basis des Nutzungswerts errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswerts ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich ist und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt sind. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab

Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS MicroTec-Gruppe nicht vor.

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

| | |
|--|-------------|
| Gebäude, Einbauten | 10–40 Jahre |
| Technische Anlagen und Maschinen | 4–5 Jahre |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3–5 Jahre |
| Fahrzeuge | 5 Jahre |

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwerts aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrags getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgt nicht.

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich

ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswerts.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS MicroTec-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie „Kredite und Forderungen“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert, da sie nicht zu Spekulationszwecken gehalten werden. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert.

Beitragsorientierte Pläne („Defined Contribution Plans“) führen in der Regel nicht zu einer Rückstellungsbildung, da sich die Verpflichtung des Unternehmens auf die Zahlung von Beiträgen an den Versorgungsträger/Fonds beschränkt. Die Prämienzahlungen an die Versorgungsträger/Fonds werden in der Periode ihres Anfalls als Aufwand erfasst.

Bei leistungsorientierten Plänen („Defined Benefit Plans“) besteht die Verpflichtung des Unternehmens in der Gewährung der zugesagten Leistungen an aktive und frühere Arbeitnehmer. Leistungsorientierte Pläne führen in der Regel zur Bildung von Pensionsrückstellungen.

Die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung abzüglich bewerteten Planvermögens) wird mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Planvermögen). Die Effekte aus der Neubewertung der Nettoschuld (versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, Erträge aus dem

Planvermögen sowie die Veränderungen in der Auswirkung der Vermögensobergrenze) werden in voller Höhe im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuerrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.

Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie „finanzielle Verbindlichkeiten“ zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Leasing

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf Basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt, selbst wenn dieses Recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

Bei Leasingvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden, gilt in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften von IFRIC 4 der 1. Januar 2005 als Zeitpunkt des Abschlusses der Leasingvereinbarung.

Finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur Aktivierung des Leasinggegenstands zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in Finanzierungsaufwendungen und den Tilgungsanteil der Restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. Finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

Leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands abgeschrieben. Ist der Eigentumsübergang auf den Konzern am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig abgeschrieben. Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand für Operating-Leasingverhältnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart sind, der Umsatz erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, wenn ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS MicroTec-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow-Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Cashflow-Hedges

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow-Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden von diesen abgesetzt.

Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

E) VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturlagen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2016 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 396 Tsd. € (Vorjahr: 471 Tsd. €).

Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich für die Cash Generating Unit Lithografie, der der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 1,5 % (Vorjahr: 9,0 %). Nach dem Ende des fünfjährigen Planungshorizonts wird für die folgenden Jahre eine Umsatzsteigerungsrate von 1,0 % p. a. angenommen. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 8,8 % (Vorjahr: 8,5 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrunde liegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sie werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Abhängig vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen sind Schätzungen notwendig, um den wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag zu bestimmen.

Purchase-Price-Allocation

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte,

Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

F) KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die SÜSS MicroTec AG sowie alle aktiven Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Beherrschung liegt vor, wenn die SÜSS MicroTec AG die Verfügungsgewalt hat, an positiven und negativen variablen Rückflüssen einer Gesellschaft zu partizipieren, und diese Rückflüsse durch ihre Verfügungsgewalt beeinflussen kann. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

| | 2016 | | 2015 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Bilanz | G&V | Bilanz | G&V |
| 1 EUR vs. 1 USD | 1,056 | 1,103 | 1,089 | 1,113 |
| 1 EUR vs. 1 JPY | 123,494 | 121,096 | 131,129 | 134,473 |
| 1 EUR vs. 1 GBP | 0,858 | 0,816 | 0,735 | 0,728 |
| 1 EUR vs. 1 CHF | 1,075 | 1,090 | 1,082 | 1,075 |
| 1 EUR vs. 1 TWD | 33,947 | 35,548 | 35,984 | 35,348 |
| 1 EUR vs. 1 SGD | 1,526 | 1,526 | 1,540 | 1,528 |
| 1 EUR vs. 1 CNY | 7,361 | 7,326 | 7,092 | 6,944 |
| 1 EUR vs. 1 KRW | 1.267,230 | 1.285,520 | 1.284,770 | 1.260,293 |

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 ergaben sich keine Veränderungen im Konsolidierungskreis.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung).

| Gesellschaft / Sitz | Währung | Gezeichnetes Kapital | Beteiligung | Eigenkapital | Jahresergebnis | Konsolidierung |
|--|---------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| SÜSS MicroTec AG, Garching ¹ | EUR | 19.115.538,00 | Holding | 62.903.100,73 | -24.744.930,49 | voll |
| SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching ² | EUR | 2.000.100,00 | 100 % | 52.408.891,39 | 11.682.415,14 | voll |
| SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels | EUR | 3.000.000,00 | 100 % | 3.000.000,00 | 2.314.974,00 | voll |
| SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs-GmbH, Sternenfels | EUR | 25.000,00 | 100 % | 13.454,81 | -708,69 | voll |
| SUSS MicroTec Ltd., Market Rasen, Vereinigtes Königreich | GBP | 10.000,00 | 100 % | 231.758,00 | 32.346,01 | voll |
| SUSS MicroTec KK, Yokohama, Japan | JPY | 30.000.000,00 | 100 % | -632.845.293,00 | -5.166.768,00 | voll |
| SUSS MicroTec SARL, Pierre Bénite, Frankreich | EUR | 114.750,00 | 100 % | 1.712.898,51 | 829.325,59 | voll |
| SUSS MicroOptics S.A., Hauterive, Schweiz | CHF | 500.000,00 | 100 % | 10.477.523,64 | 1.548.355,25 | voll |
| SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA | USD | 4.197.000,00 | 100 % | 22.480.122,59 | 421.277,59 | voll |
| SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu, Taiwan | TWD | 5.000.000,00 | 100 % | 228.396.106,00 | 71.699.592,00 | voll |
| SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai, China | CNY | 1.655.320,00 | 100 % | 49.856.521,37 | 7.957.951,84 | voll |
| HUGLE Lithography Inc., San Jose, USA ³ | USD | 1.190.442,00 | 53,1% | -40.379,00 | -800,00 | – |
| SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim ² | EUR | 25.564,59 | 100 % | 1.453.753,40 | 1.247.881,34 | voll |
| SUSS MicroTec (Singapore) Pte. Ltd., Singapur | SGD | 25.000,00 | 100 % | 5.618.248,63 | 2.112.267,20 | voll |
| SUSS MicroTec Korea Co. Ltd., Hwaseong City, Korea | KRW | 50.000.000,00 | 100 % | 2.519.702.683,00 | -731.603.344,00 | voll |
| SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA | USD | 10.400,00 | 100 % | -19.603.869,80 | 775.210,07 | voll |

¹ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH und vor Berücksichtigung der Ergebniszurechnung von der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG.

² Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrags mit der SÜSS MicroTec AG.

³ Wegen Unwesentlichkeit keine Konsolidierung.

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, und die SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264 b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(3) UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Maschinen | 136.583 | 111.660 |
| Ersatzteile und Upgrades | 19.866 | 18.349 |
| Serviceleistungen | 11.276 | 11.603 |
| Mikrooptik | 9.857 | 6.836 |
| Sonstige | 0 | 68 |
| Umsatzerlöse | 177.582 | 148.516 |

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung.

(4) UMSATZKOSTEN

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 74 Tsd. € (Vorjahr: 132 Tsd. €) enthalten, die komplett auf das Segment Lithografie entfallen. Der zum 31. Dezember 2016 verbleibende Restbuchwert der aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 178 Tsd. € betrifft ebenfalls – wie auch im Vorjahr – ausschließlich das Segment Lithografie.

In den Umsatzkosten des aktuellen Geschäftsjahres sind darüber hinaus planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 297 Tsd. € (Vorjahr: 288 Tsd. €) enthalten. Diese Technologie weist zum 31. Dezember 2016 einen Restbuchwert von 966 Tsd. € auf.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von 5.500 Tsd. € (Vorjahr: 5.056 Tsd. €) eingeflossen. Dabei entfallen 4.658 Tsd. € (Vorjahr: 3.533 Tsd. €) auf Bestände des Segments Lithografie und 765 Tsd. € (Vorjahr: 1.364 Tsd. €) auf Bestände des Segments Bonder. Die Bestände des Segments Fotomasken-Equipment wurden um 77 Tsd. € (Vorjahr: 158 Tsd. €) abgewertet.

(5) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Fremdwährungsgewinne | 2.617 | 2.962 |
| Erträge aus einer Stornovereinbarung mit einem Kunden | 0 | 607 |
| Provisionen | 935 | 467 |
| Kfz-Sachbezüge | 240 | 229 |
| Auflösung von sonstigen Verpflichtungen | 0 | 182 |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 94 | 51 |
| Ablöse Mietereinbauten Sunnyvale (SMT Inc.) | 0 | 67 |
| Rückstellungsaufösungen | 49 | 76 |
| Sonstige Zuschüsse | 42 | 39 |
| Mieterträge | 49 | 32 |
| Sonstiges | 242 | 157 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.268 | 4.869 |

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem sind hier Erträge aus der Stichtagsbewertung von konzerninternen Verrechnungskonten erfasst, die aus Sicht der bilanzierenden Gesellschaft in Fremdwährung bestehen.

Die Provisionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt.

Von den sonstigen Zuschüssen wurden 40 Tsd. € von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt, während 2 Tsd. € auf die SUSS MicroTec Lithography GmbH entfielen. Die Zuschüsse des Vorjahres in Höhe von 39 Tsd. € betrafen ausschließlich Zuschüsse an SUSS MicroTec China.

(6) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Fremdwährungsverluste | 2.670 | 3.157 |
| Sonstige Steuern | 710 | 576 |
| Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | 23 | 368 |
| Aufwendungen für eine Stornovereinbarung mit einem Kunden | 0 | 135 |
| Verluste aus Anlagenabgang | 52 | 0 |
| Sonstiges | 33 | 138 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.488 | 4.374 |

Die Fremdwährungsverluste entstanden – wie im Vorjahr – im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in US-Dollar aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung.

(7) FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzerträge in Höhe von 91 Tsd. € (Vorjahr: 258 Tsd. €) resultierten im Wesentlichen aus Zinserträgen für Geldmarktanlagen und Wertpapiere.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|------------|------------|
| Bankverbindlichkeiten | 676 | 383 |
| Avalprovisionen | 36 | 34 |
| Buchverluste aus der Einlösung von Wertpapieren | 0 | 71 |
| Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen | 8 | 38 |
| Finanzaufwendungen | 720 | 526 |

Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten betrafen im Wesentlichen die Grundstücksfinanzierungen in Garching und Sternenfels. In den Zinsen für Bankverbindlichkeiten sind 187 Tsd. € (Vorjahr: 224 Tsd. €) enthalten, die auf die Grundstücksfinanzierung in Garching entfallen (Darlehensstand zum 31. Dezember 2016: 4.500 Tsd. €). Das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels wurde im ersten Halbjahr 2016 gekündigt und zum 30. Juni 2016 komplett getilgt. Der damit verbundene Swap wurde aufgelöst. In den Zinsen für Bankverbindlichkeiten sind 42 Tsd. € Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierung in Sternenfels sowie 434 Tsd. € für die Ablösung des damit verbun-

denen Swaps erfasst. Weitere Erläuterungen zur Auflösung des Darlehens Sternenfels finden sich unter Punkt (24) dieses Anhangs.

Die Buchverluste aus der Einlösung von Wertpapieren des Vorjahres resultierten aus dem unterjährigen Erwerb von Unternehmensanleihen, deren Kaufpreis über dem Nominalwert lag. Die erworbenen Anleihen wiesen eine kurze Restlaufzeit auf und wurden vor dem 31. Dezember 2015 fällig. Die Einlösung bei Fälligkeit erfolgte zum Nominalwert.

(8) ERTRAGSTEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Laufender Steueraufwand | 5.347 | 2.975 |
| Latenter Steuerertrag (-)/-aufwand | 170 | 1.505 |
| davon auf temporäre Differenzen | -3 | -420 |
| Gesamtaufwand | 5.517 | 4.480 |

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

| in % | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Angenommener Steuersatz | | |
| Körperschaftsteuer | 15,00 | 15,00 |
| Solidaritätszuschlag | 5,50 | 5,50 |
| Gewerbsteuer | 12,43 | 12,43 |
| Kombinierter Steuersatz | 28,25 | 28,25 |

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|---------------|--------------|
| Ergebnis vor Steuern | 10.519 | 4.705 |
| Erwartete Ertragsteuern | 2.972 | 1.329 |
| Abweichende Steuersätze im Ausland | -1.716 | -1.505 |
| Mindestbesteuerung | 35 | 0 |
| Gewerbsteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen | 6 | 8 |
| Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | 274 | 198 |
| Steueraufwand Vorjahre | 96 | 219 |
| Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern | 4.320 | 4.382 |
| Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge | -467 | 0 |
| Steuerfreie Erträge | -26 | -27 |
| Steuerliche Zuschüsse | 0 | -71 |
| Sonstiges | 23 | -53 |
| Effektive Ertragsteuern | 5.517 | 4.480 |

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von -2.545 Tsd. € (Vorjahr: -3.151 Tsd. €). Anstatt eines erwarteten Steueraufwands in Höhe von 2.972 Tsd. € ergab sich auf Konzernebene im Berichtsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 5.517 Tsd. €.

Im Berichtsjahr wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von 4.320 Tsd. € gebildet. Der größte Wertberichtigungsbedarf entstand bei der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, Kalifornien, USA. Die beiden US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc. und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bilden eine „Tax-Group“, deren zu versteuerndes Einkommen in den USA der Gruppenbesteuerung unterliegt. Auf Basis der aktuellen Konzernplanung wird für die SUSS MicroTec Photonic Systems in den nächsten drei Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Das Ergebnis der SUSS MicroTec, Inc. wird in den kommenden Jahren voraussichtlich leicht positiv sein.

Der Steueraufwand für Vorjahre betrifft im Wesentlichen Steuernachzahlungen der SÜSS MicroTec AG, die sich aus der letzten Betriebsprüfung ergeben haben.

Bei der SUSS MicroTec SARL., Pierre Bénite, Frankreich, und bei der SUSS MicroTec, Inc., Corona, USA, konnte in 2016 jeweils ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Daraus ergab sich ein positiver Steuereffekt aus der Inanspruchnahme wertberichtigter Verlustvorträge.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

| | Aktiva | | Passiva | |
|---|--------------|--------------|----------|----------|
| | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 132 | 89 | 0 | 0 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.183 | 1.160 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 62 | 0 | 0 | 2 |
| Langfristige Rückstellungen | 12 | 0 | 3 | 3 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.071 | 1.503 | 0 | 0 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 0 | 101 | 70 | 1 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 0 | 0 | 2.064 | 2.064 |
| Passiver Ausgleichsposten SMT Photomask Equipment | 0 | 0 | 250 | 303 |
| Vorräte | 1.927 | 1.450 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | 9 | 12 | 0 | 0 |
| Sonstiges | 64 | 117 | 33 | 16 |
| Verlustvorträge | 165 | 410 | 0 | 0 |
| Saldierung | -2.420 | -2.389 | -2.420 | -2.389 |
| Gesamt | 2.205 | 2.453 | 0 | 0 |

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 49.770 Tsd. € (Vorjahr: 54.554 Tsd. €). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 insgesamt 6.001 Tsd. €. Im Zeitraum von 2026 bis 2035 verfallen insgesamt 43.664 Tsd. €. Verlustvorträge in Höhe von 105 Tsd. € sind unbegrenzt nutzbar.

Im Mai 2016 hat die SÜSS MicroTec AG gegenüber der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, USA, einen Forderungsverzicht in Höhe von 15 Mio. USD ausgesprochen. Der daraus bei der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. resultierende Ertrag ist in den USA nicht steuerbar. Allerdings wurden die bestehenden Verlustvorträge um 15 Mio. USD gekürzt. Die dem Konzern zur Verfügung stehenden Verlustvorträge reduzierten sich dadurch in 2016 entsprechend.

Aus ihrem operativen Geschäft erzielte die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. jedoch erneut ein deutlich negatives Jahresergebnis. Auch die SUSS MicroTec Korea Company Ltd. steuerte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust zum Konzernergebnis bei.

Die Gesellschaften SUSS MicroTec SARL, Frankreich, und SUSS MicroTec, Inc., USA, konnten hingegen ein positives Jahresergebnis erreichen und dadurch bestehende Verlustvorträge nutzen. Die in Deutschland noch im Vorjahr vorhandenen Verlustvorträge von 1.452 Tsd. € wurden in 2016 komplett durch das deutlich positive steuerliche Ergebnis der in Deutschland bestehenden Organschaft (SÜSS MicroTec AG, SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec REMAN GmbH) ausgeglichen.

Für Verlustvorträge in Höhe von 49.074 Tsd. € (Vorjahr: 53.102 Tsd. €) und temporäre Differenzen in Höhe von 15.999 Tsd. € (Vorjahr: 12.699 Tsd. €) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

Nach IAS 12.74 f. ist eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorzunehmen, wenn zum einen eine zivilrechtliche Aufrechnungslage gegeben ist, und zum anderen die latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden.

Zum 31. Dezember 2016 wurden somit aktive und passive latente Steuern in Höhe von 2.420 Tsd. € (Vorjahr: 2.389 Tsd. €) saldiert.

(9) ERGEBNIS JE AKTIE

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie zusammen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Gewinn, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt | 5.002 | 225 |
| Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück) | 19.115.538 | 19.115.538 |
| Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück) | 0 | 0 |
| Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück) | 19.115.538 | 19.115.538 |
| Ergebnis je Aktie in € – unverwässert | 0,26 | 0,01 |
| Ergebnis je Aktie in € – verwässert | 0,26 | 0,01 |

(10) SONSTIGE ANGABEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND -VERLUSTRECHNUNG

AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Neben den in der Gewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind im Geschäftsjahr auch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten erfasst worden. Neuaktivierungen wurden in 2016 nicht vorgenommen.

Die Nettoinvestitionen und -aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|---------------|---------------|
| Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 14.137 | 12.787 |
| Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten | 74 | 132 |
| Neuaktivierungen von Entwicklungskosten | 0 | 1 |
| Nettoinvestitionen | -74 | -131 |

PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|---------------|---------------|
| Löhne und Gehälter | 52.508 | 48.462 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 6.914 | 5.804 |
| Aufwendungen für Altersvorsorge | 3.105 | 2.972 |
| Personalaufwand | 62.527 | 57.238 |

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2016 55.734 Tsd. € (Vorjahr: 48.534 Tsd. €).

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Immaterielle Vermögenswerte | 1.290 | 1.239 |
| Sachanlagen | 2.860 | 2.944 |
| Abschreibungen | 4.150 | 4.183 |

Im Geschäftsjahr wurden Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von 919 Tsd. € (Vorjahr: 819 Tsd. €) und aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 74 Tsd. € (Vorjahr: 132 Tsd. €) abgeschrieben

Die im Rahmen der Erstkonsolidierung der SÜSS MicroTec Photonic Systems angesetzte Technologie und weitere erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden mit 297 Tsd. € (Vorjahr: 288 Tsd. €) abgeschrieben.

Erläuterungen zu den Aktiva

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(11) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 2.378 Tsd. € (Vorjahr: 2.789 Tsd. €) Entwicklungsleistungen von 178 Tsd. € (Vorjahr: 252 Tsd. €) und die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 966 Tsd. € (Vorjahr: 1.225 Tsd. €) ausgewiesen. Die Technologie wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben und weist eine verbleibende Restnutzungsdauer bis zum 31. März 2020 auf. In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das konzernweite SAP-System enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen. Der Restbuchwert zum 31. Dezember 2016 betrifft allein das Segment Lithografie.

Unter den anderen immateriellen Vermögenswerten wird die im Rahmen der Unternehmensakquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems erworbene Technologie mit einem Restbuchwert von 966 Tsd. € (Vorjahr: 1.225 Tsd. €) ausgewiesen. Da der Wert der Technologie in US-Dollar erfasst und fortgeführt wurde, wirkt die Veränderung des Umrechnungskurses des US-Dollar im Vergleich zum Euro zum 31. Dezember 2016 werterhöhend.

(12) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.840 Tsd. € (Vorjahr: 15.772 Tsd. €) entfällt in voller Höhe auf die Cash Generating Unit Lithografie. Ein Teil des Goodwills (2.366 Tsd. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen.

(13) SACHANLAGEN

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

(14) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Rückdeckungsversicherung | 161 | 156 |
| Kautionen | 491 | 455 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 652 | 611 |

(15) VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Materialien und Hilfsstoffe | 29.183 | 28.610 |
| Unfertige Erzeugnisse | 25.148 | 27.237 |
| Fertigerzeugnisse | 15.014 | 11.180 |
| Demonstrationsgeräte | 24.377 | 20.032 |
| Handelswaren | 870 | 869 |
| Wertberichtigungen | -20.788 | -19.209 |
| Vorratsvermögen | 73.804 | 68.719 |

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2016 bilanzierten Vorräte in Höhe von 73.804 Tsd. € (Vorjahr: 68.719 Tsd. €) sind 33.579 Tsd. € (Vorjahr: 29.579 Tsd. €) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorräte, der im Geschäftsjahr als Aufwand erfasst wurde, beträgt rund 108.779 Tsd. € (Vorjahr: 85.244 Tsd. €).

(16) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| Forderungen gegen Dritte | 24.507 | 13.564 |
| Wertberichtigungen | -396 | -471 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.111 | 13.093 |

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres | 471 | 323 |
| Ausbuchung von Forderungen | -4 | -169 |
| Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen | -94 | -51 |
| Zuführung | 23 | 368 |
| Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende | 396 | 471 |

(17) SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|------------|------------|
| Zinsabgrenzungen | 0 | 6 |
| Lieferantenboni | 106 | 118 |
| Bietungsgarantien | 5 | 38 |
| Mitarbeiterforderungen | 21 | 24 |
| Sonstiges | 27 | 35 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 159 | 221 |

(18) STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE

Die langfristigen Steuerforderungen resultierten im Vorjahr im Wesentlichen aus der Aktivierung des Körperschaftsteuerguthabens deutscher Konzerngesellschaften infolge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Für 2017 erwarten die deutschen Gesellschaften noch eine Rückzahlung

von 17 Tsd. €; dieser Anspruch wird nun unter den kurzfristigen Steuerforderungen ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag in Höhe von 34 Tsd. € wurde unter den langfristigen Steuerforderungen ausgewiesen.

Die kurzfristigen Steuerforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|------------|------------|
| Geleistete Steuervorauszahlungen | 208 | 264 |
| Körperschaftsteuerguthaben der deutschen Gesellschaften | 17 | 0 |
| Steuerliche Zuschüsse | 150 | 150 |
| Steuererstattungsansprüche | 375 | 414 |

(19) ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

Bei den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 35.621 Tsd. € (Vorjahr: 49.085 Tsd. €) handelt es sich um Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten, die innerhalb von drei Monaten vom Zeitpunkt der Einlage verfügbar sind. Die Veränderung zum Vorjahr wird in der Konzernkapitalflussrechnung dargestellt.

(20) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 899 | 822 |
| Geleistete Anzahlungen | 563 | 400 |
| Umsatzsteuer | 1.109 | 804 |
| Bietungsgarantien | 105 | 100 |
| Scheckforderungen | 0 | 44 |
| Sonstiges | 98 | 102 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 2.774 | 2.272 |

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, z. B. Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

Erläuterungen zu den Passiva

(21) EIGENKAPITAL

GEZEICHNETES KAPITAL

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Bilanzstichtag unverändert 19.115.538,00 € (eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen lautende und voll einbezahlte Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €). Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapital-Veränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 2.500 Tsd. € (Vorjahr: 9.000 Tsd. €).

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---------------------|--------|--------|
| Grundkapital | 19.116 | 19.116 |
| Genehmigtes Kapital | 2.500 | 9.000 |
| Bedingtes Kapital | 0 | 0 |

RÜCKLAGEN

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|------------------|----------------|---------------|
| Kapitalrücklage | 71.547 | 97.614 |
| Gewinnrücklage | 433 | 433 |
| Bilanzgewinn | 31.831 | 762 |
| Rücklagen | 103.811 | 98.809 |

Die SÜSS MicroTec AG hat im Geschäftsjahr eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 26.067 Tsd. € vorgenommen, um ihren Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2016 von 9.500 Tsd. € sowie ihren Verlustvortrag aus den Vorjahren von 16.568 Tsd. € auszugleichen. Dadurch hat sich die Kapitalrücklage des SÜSS MicroTec-Konzerns um 26.067 Tsd. € reduziert.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Entnahme aus der Kapitalrücklage der SÜSS MicroTec AG von 26.067 Tsd. € führt im Konzern zu einem entsprechend höheren Bilanzgewinn. Zusammen mit dem positiven Jahresergebnis

des Konzerns von 5.002 Tsd. € ergibt sich zum 31. Dezember 2016 ein Bilanzgewinn in Höhe von 31.831 Tsd. €.

KUMULIERTES ÜBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|--------------|---------------|
| Neubewertung von leistungsorientierten Plänen | -2.845 | -2.313 |
| Fremdwährungsanpassungen | 3.258 | 493 |
| Absicherung künftiger Zahlungsströme | -410 | -486 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren | 0 | 11 |
| Steuereffekte | | |
| Neubewertung von leistungsorientierten Plänen | 697 | 532 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren | 0 | -3 |
| Absicherung künftiger Zahlungsströme | 115 | 137 |
| Stand zu Beginn der Periode | 815 | -1.629 |
| Veränderungen vor Steuern | | |
| Neubewertung von leistungsorientierten Plänen | -168 | -532 |
| Fremdwährungsanpassungen | 415 | 2.765 |
| Absicherung künftiger Zahlungsströme | 410 | 76 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren | 0 | -11 |
| Steuereffekte | | |
| Neubewertung von leistungsorientierten Plänen | 69 | 165 |
| Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapieren | 0 | 3 |
| Absicherung künftiger Zahlungsströme | -115 | -22 |
| Stand am Ende der Periode | 1.426 | 815 |

Die SÜSS MicroTec AG hat 2010 einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge-Accounting angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde das Darlehen vorzeitig abgelöst und komplett getilgt. Der Swap wurde im April 2016 glattgestellt. Der bisher im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildete Betrag in Höhe von -410 Tsd. €, der die Marktwertänderungen des Swaps widerspiegelte, wurde ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung im Finanzergebnis erfasst. Gleichzeitig wurden die damit verbundenen

latentem Steuern in Höhe von 115 Tsd. € in die Gewinn- und Verlustrechnung umgliedert.

EIGENKAPITALMANAGEMENT

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns – bestehend aus dem gezeichneten Kapital, den Rücklagen und dem kumulierten übrigen Eigenkapital – beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf insgesamt 124.353 Tsd. € (Vorjahr: 118.740 Tsd. €); das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,2 % (Vorjahr: 67,0 %). Neben einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität strebt der SÜSS MicroTec-Konzern eine nachhaltig hohe Eigenkapitalquote sowie eine hohe Liquiditätsreserve an, um künftiges Wachstum sicherzustellen und den Unternehmenswert zu steigern. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern alle Möglichkeiten nutzen, die die Börsennotierung der SÜSS MicroTec AG mit sich bringt.

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr ein positives Ergebnis zu erzielen. Bei einer Verfehlung der Planung besteht die Gefahr, dass sich das Eigenkapital infolge eines Jahresfehlers betrags verringern könnte.

(22) PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich in der Regel auf Basis der Gehälter und der Dauer der Betriebszugehörigkeit der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Barwert der Pensionsverpflichtungen | 9.431 | 9.003 |
| Zeitwert des Planvermögens | -4.594 | -3.859 |
| Errechnete Pensionsverbindlichkeit | 4.837 | 5.144 |

LEISTUNGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED BENEFIT PLANS“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

| in % | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| Abzinsungssatz | 1,43 | 1,91 |
| Erwartete Rendite auf das Planvermögen | 1,43 | 1,91 |
| Gehaltssteigerung | 0,00 | 0,00 |
| Rentensteigerung | 2,00 | 2,00 |

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

| in % | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| Abzinsungssatz | 0,65 | 0,90 |
| Erwartete Rendite auf das Planvermögen | 0,65 | 0,90 |
| Gehaltssteigerung | 1,50 | 1,50 |
| Rentensteigerung | 0,00 | 0,00 |

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

| in % | 2016 | 2015 |
|-------------------|------|------|
| Abzinsungssatz | 0,00 | 0,42 |
| Gehaltssteigerung | 2,36 | 1,67 |
| Rentensteigerung | 0,00 | 0,00 |

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und beizulegenden Zeitwerte des Planvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2016 und 2015 wie folgt entwickelt:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Anwartschaftsbarwert am 1.1. | 9.003 | 7.278 |
| Dienstzeitaufwand | 633 | 337 |
| Zinsaufwand | 107 | 109 |
| Pensionszahlungen | -554 | 482 |
| Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus Veränderungen der finanziellen Annahmen | 308 | 186 |
| Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus Veränderungen der demographischen Annahmen | -461 | 0 |
| Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust aus erfahrungsbedingten Anpassungen | 309 | 174 |
| Währungsveränderungen | 86 | 437 |
| Anwartschaftsbarwert am 31.12. | 9.431 | 9.003 |

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Planvermögen am 1.1. | 3.859 | 2.527 |
| Erwartete Erträge aus dem Planvermögen | 42 | 36 |
| Geleistete Fondsdotierungen | 634 | 1.052 |
| Versicherungsmathematischer (+) Gewinn/(-) Verlust | 38 | 53 |
| Währungsveränderungen | 21 | 191 |
| Planvermögen am 31.12. | 4.594 | 3.859 |

Die wesentlichen Komponenten des Planvermögens sind Rückdeckungsversicherungen. Im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen in Deutschland wurden entsprechende Rückdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. Die Pensionsverpflichtungen in der Schweiz sind über die Helvetia Sammelstiftung abgesichert, die hierfür entsprechende Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen hat. Die beiden Rückdeckungsversicherungen sind als konservative, risikoarme Anlageform zu sehen, deren Wert nur geringen Marktschwankungen unterliegt.

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von 6.841 Tsd. € (Vorjahr: 6.778 Tsd. €) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|------------|------------|
| Dienstzeitaufwand | 633 | 337 |
| Personalaufwandskomponente | 633 | 337 |
| Zinsaufwand | 107 | 109 |
| Erwartete Erträge aus dem Planvermögen | -14 | -15 |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste | -4 | 19 |
| Zinsaufwandskomponente | 89 | 113 |

Für 2017 erwartet der Konzern zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen Zahlungsmittelabflüsse von insgesamt 420 Tsd. €. In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, in welcher Weise der Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen durch Veränderungen der maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen beeinflusst worden wäre:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---|------|------|
| Veränderung des Barwerts aller definierten Leistungsverpflichtungen, falls | | |
| der Abzinsungssatz 50 Basispunkte niedriger wäre | 741 | 689 |
| der Abzinsungssatz 50 Basispunkte höher wäre | -639 | -599 |
| die Lohnsteigerung 50 Basispunkte niedriger wäre | -128 | -110 |
| die Lohnsteigerung 50 Basispunkte höher wäre | 130 | 114 |
| die künftige Rentensteigerung 0,50% niedriger wäre | -400 | -379 |
| die künftige Rentensteigerung 0,50% höher wäre | 440 | 410 |

BEITRAGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED CONTRIBUTION PLANS“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Von dem Plan profitieren alle Mitarbeiter der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, und der SUSS MicroTec, Inc., Corona, ab einem Alter von 18 bzw. 21 Jahren und einem Minimum an geleisteten Arbeitsstunden von 1.000 Stunden pro Jahr. Beide „Defined Contribution Plans“ beinhalten zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401-(k)-Plan.

Bei der SUSS MicroTec, Inc. werden die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust-Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401-(k)-Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag 0,50 USD für jeden 1,00 USD des Arbeitnehmerbeitrags bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von 3.000 USD (d. h., der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt 1.500 USD). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Der 401-(k)-Plan der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 25% ihrer jährlichen Vergütung in den 401-(k)-Plan einzubezahlen. Für jeden Arbeitnehmerbeitrag von 1,00 USD wird ein Arbeitgeberbeitrag von 1,00 USD beigesteuert bis zu einem Maximalbetrag von 3% des Gehalts. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen einen unverfallbaren Leistungsanspruch gestaffelt in 20-Prozent-Schritten über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Im Geschäftsjahr 2016 betrugen die Aufwendungen des Konzerns für den 401-(k)-Plan 172 Tsd. USD (Vorjahr: 131 Tsd. USD).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 2.949 Tsd. € (Vorjahr: 2.841 Tsd. €) abgeführt.

(23) (LANGFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die langfristigen Rückstellungen beinhalteten im Vorjahr Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

| in Tsd. € | Stand 01.01.16 | Verbrauch | Zuführung | Stand 31.12.16 |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Altersteilzeit | 11 | -11 | 0 | 0 |

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Alters- teilzeitregelung galt für Arbeitnehmer der SUSS MicroTec Litho- graphy GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet hatten und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung ausgeübt hatten.

Während der Dauer der Altersteilzeit wurde die bisherige Regel- arbeitszeit auf 50% reduziert. Die während der Altersteilzeit- Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wurde regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteil- zeit geleistet wurde (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wurde (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50% reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhielt der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen war, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82% des monatlichen Vollzeit-Nettoarbeitsentgelts betrug. Der Auf- stockungsbetrag wurde steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(24) FINANZSCHULDEN

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten ergibt sich zum 31. Dezember 2016 bzw. zum Vorjahres- stichtag wie folgt:

| 31.12.2016 in Tsd. € | Restlaufzeit bis zu einem Jahr | Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren | Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | Summe |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------|
| Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.000 | 3.500 | 0 | 4.500 |
| Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Gesamt | 1.007 | 3.500 | 0 | 4.507 |

| 31.12.2015 in Tsd. € | Restlaufzeit bis zu einem Jahr | Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren | Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren | Summe |
|--|--------------------------------------|---|---|--------------|
| Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.180 | 7.420 | 500 | 9.100 |
| Kontokorrentverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Gesamt | 1.186 | 7.420 | 500 | 9.106 |

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthielten im Vorjahr Verbindlichkeiten aus zwei langfristigen Darlehensverträgen, die der Finanzierung der Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels dienten.

Der Darlehensvertrag für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels wurde am 25./28. Mai 2010 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf 4,5 Mio. €, hatte eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 und war mit einem variablen Zins belegt. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht. Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos hat die SÜSS MicroTec AG gleichzeitig zum Darlehensvertrag in 2010 einen laufzeit- und betragskongruenten Zinsswap abgeschlossen, mit dem der variable Zins des Darlehens in einen fixen Zins eingetauscht wurde. Unter Berücksichtigung des Zinsswaps entstanden so für das Darlehen jährlich fixe Zinsen von 3,98 % p. a.

Zur bilanziellen Abbildung des Zinsswaps wurde Hedge-Accounting angewendet: Anstatt Marktwertänderungen des Zinsswaps in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen, wurden diese im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet. Zum 31. Dezember 2015 wies der Zinsswap einen negativen Marktwert von 410 Tsd. € auf; die Restschuld aus dem Darlehen belief sich auf 3.600 Tsd. €.

Aufgrund der aktuellen Marktinzsentwicklung und des hohen Bestands an liquiden Mitteln im SÜSS MicroTec Konzern hat die SÜSS MicroTec AG entschieden, dieses Darlehen vorzeitig abzulösen. Zum 30. Juni 2016 wurde der gesamte noch ausstehende Darlehensbetrag von 3.600 Tsd. € getilgt. Der Swap wurde im April 2016 glattgestellt. Dadurch ist das Finanzergebnis 2016 mit Aufwendungen von rund 434 Tsd. € belastet, die bisher im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst waren und bei einer Weiterführung des Darlehens und des Swaps verteilt über einen Zeitraum bis zum 30. Juni 2020 im Finanzergebnis angefallen wären. Mit der vorzeitigen Ablösung des Darlehens werden insgesamt Einsparungen von Zinsen und Steuern von ca. 0,1 Mio. € erzielt werden.

Der Darlehensvertrag für die Grundstücksfinanzierung Garching wurde am 23./28. Oktober 2013 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 und weist einen fixen Zinssatz von 3,65 % auf. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht. Dieses Darlehen besteht unverändert weiter. Die Restschuld aus diesem Darlehen beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 4.500 Tsd. € (Vorjahr: 5.500 Tsd. €).

Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

| Konzerngesellschaft in Tsd. € | 2016 | 2015 | Zinssatz | Fälligkeit |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------|
| SÜSS MicroTec AG | 0 | 3.600 | 3,98% | Wurde in 2016 getilgt |
| SÜSS MicroTec AG | 4.500 | 5.500 | 3,65% | 30.6.2021 |
| Gesamt | 4.500 | 9.100 | | |
| davon kurzfristig fällig | 1.000 | 1.180 | | |
| davon langfristig fällig | 3.500 | 7.920 | | |
| fällig in 2017 | 1.000 | | | |
| 2018 | 1.000 | | | |
| 2019 | 1.000 | | | |
| 2020 | 1.000 | | | |
| 2021 | 500 | | | |
| | 4.500 | | | |

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

| in Tsd. € | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Kredit- / Avallinie | 5.250 | 9.000 |
| Inanspruchnahme in Form von Avalen | 2.764 | 5.443 |
| Verfügbare Kredit- / Avallinie | 2.486 | 3.557 |

Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank AG und unter Beteiligung der DZ Bank AG und der Baden-Württembergischen Bank stellt Kredit- und Avallinien in Höhe von 4,5 Mio. €. Diese Linien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Die Linien können von der SÜSS MicroTec AG oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden.

Die BW-Bank Mannheim gewährt der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG eine Kredit- und Avallinie in Höhe von 750 Tsd. €. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt.

Zum Bilanzstichtag sind die Linien in Höhe von 2.764 Tsd. € (Vorjahr: 5.443 Tsd. €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien in Form von Avalen betrug 1,11 % (Vorjahr: 1,00 %).

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE-LEASE

Der Konzern least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- als auch im Verwaltungsbereich unter Operating-Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich technischer Anlagen und Maschinen sowie anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance-Lease-Verträge, deren zugrunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating-Lease stellen sich wie folgt dar:

| <i>in Tsd. €</i> | Finance Lease | Operating Lease |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Abschreibungen / Aufwendungen 2016 | 7 | 1.121 |
| Abschreibungen / Aufwendungen 2015 | 7 | 1.262 |
| Künftige Verpflichtungen | | |
| fällig in 2017 | 0 | 923 |
| 2018 | 0 | 323 |
| 2019 | 0 | 233 |
| 2020 | 0 | 89 |
| 2021 | 0 | 10 |
| später | 0 | 0 |
| Gesamt zukünftig | 0 | 1.578 |

(25) (KURZFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|--------------|--------------|
| Garantierückstellungen | 2.522 | 1.574 |
| Rückstellung für die Abfindung eines Vorstandsmitglieds | 750 | 0 |
| Rückstellung für die Neuausrichtung Vertrieb Japan | 1.205 | 0 |
| Übrige Rückstellungen | 684 | 788 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 5.161 | 2.362 |

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Rückstellungen für Abfindungen entfallen in voller Höhe auf ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied.

Die Rückstellung für die Neuausrichtung des Vertriebs in Japan enthält Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern, die SÜSS MicroTec verlassen werden, in Höhe von rund 926 Tsd. €. Diese Mitarbeiter haben Anspruch auf Auszahlung ihrer angesparten Altersbezüge und auf Auszahlung von Abfindungen. Die Abfindungsbeträge beliefen sich auf rund 276 Tsd. € und wurden aufwandswirksam erfasst. Für die Altersbezüge wurden bereits in den Vorjahren kontinuierlich Pensionsrückstellungen gebildet. Zum 31. Dezember 2016 wurden davon rund 650 Tsd. € in die kurzfristigen sonstigen Rückstellungen umgebucht. Im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Vertriebs in Japan wurden darüber hinaus Rückstellungen in Höhe von rund 279 Tsd. € gebildet für den Rückbau der von der SÜSS MicroTec KK bisher angemieteten Räumlichkeiten sowie für ausstehende Mietverpflichtungen.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Nachlaufkosten sowie Personalarückstellungen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

| <i>in Tsd. €</i> | Stand 01.01.2016 | Verbrauch | Auflösung | Zuführung | Stand 31.12.2016 |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Garantierückstellungen | 1.574 | -1.574 | 0 | 2.522 | 2.522 |
| Abfindungen | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| Rückstellung für die Neuausrichtung Vertrieb Japan | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 1.205 |
| Übrige Rückstellungen | 788 | -739 | -49 | 684 | 684 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 2.362 | -2.313 | -49 | 5.161 | 5.161 |

(26) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Prämien und Provisionen | 2.607 | 3.886 |
| Fremdleistungen | 1.538 | 1.266 |
| Aufsichtsratsvergütung | 203 | 188 |
| Negative Marktwerte aus Zinsswaps | 0 | 410 |
| Devisentermingeschäfte | 289 | 34 |
| Bedingte Kaufpreisverpflichtung SMO | 0 | 92 |
| Noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer | 509 | 449 |
| Lizenzgebühren | 26 | 99 |
| Kreditorische Debitoren | 138 | 39 |
| Sonstiges | 49 | 82 |
| Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten | 5.359 | 6.545 |

Die Gesellschaft wies im Vorjahr unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte der Zinsderivate aus. Der noch im Vorjahr bestehende Swap, der der Zinssicherung der Grundstücksfinanzierung Sternenfels diente, wurde im April 2016 glattgestellt. Weitere Informationen zur Ablösung des Swaps sind unter Textziffer (24) „Finanzschulden“ zu finden. Zum 31. Dezember 2016 bestanden keine weiteren Zinsderivate.

(27) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|--|---------------|---------------|
| Erhaltene Anzahlungen | 22.600 | 18.176 |
| Abgegrenzte Personalkosten | 4.555 | 4.394 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 443 | 366 |
| Umsatzsteuer | 127 | 228 |
| Sonstiges | 501 | 302 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 28.226 | 23.466 |

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet. In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(28) STEUERSCHULDEN

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von 2.873 Tsd. € (Vorjahr: 2.787 Tsd. €) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von 948 Tsd. € (Vorjahr: 540 Tsd. €).

Sonstige Angaben

(29) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER FINANZINSTRUMENTE

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommenen wirtschaftlichen Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andererseits Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| Finanzielle Vermögenswerte | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 35.621 | 49.085 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 0 | 0 |
| Kredite und Forderungen | 24.270 | 13.314 |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte | 0 | 0 |
| | 59.891 | 62.399 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | | |
| Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten | 289 | 445 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | 12.939 | 23.711 |
| | 13.228 | 24.156 |

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | | Bewertungskategorien gem. IAS 39 |
|--|----------|-----------|----------------------------------|
| | Buchwert | Marktwert | |
| Finanzielle Vermögenswerte | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 35.621 | 35.621 | Kredite und Forderungen |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.111 | 24.111 | Kredite und Forderungen |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 159 | 159 | Kredite und Forderungen |
| bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 159 | 159 | Kredite und Forderungen |
| bewertet zum Marktwert | 0 | 0 | Kredite und Forderungen |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.362 | 3.362 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| Finanzschulden | 4.507 | 4.947 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.507 | 4.947 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| Verbindlichkeiten aus Finance-Lease | 0 | 0 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 5.359 | 5.359 | |
| bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 5.070 | 5.070 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| bewertet zum Marktwert (Fair Value, Stufe 2) | 289 | 289 | Derivate |

| in Tsd. € | 2015 | | Bewertungskategorien gem. IAS 39 |
|--|----------|-----------|----------------------------------|
| | Buchwert | Marktwert | |
| Finanzielle Vermögenswerte | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 49.085 | 49.085 | Kredite und Forderungen |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.093 | 13.093 | Kredite und Forderungen |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 221 | 221 | Kredite und Forderungen |
| bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 221 | 221 | Kredite und Forderungen |
| bewertet zum Marktwert | 0 | 0 | Kredite und Forderungen |
| Finanzielle Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.472 | 8.472 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| Finanzschulden | 9.106 | 10.266 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 9.100 | 10.260 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| Verbindlichkeiten aus Finance-Lease | 6 | 6 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 6.578 | 6.578 | |
| bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten | 6.133 | 6.133 | Fortgeführte Anschaffungskosten |
| bewertet zum Marktwert (Fair Value, Stufe 2) | 445 | 445 | Derivate |

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Finance-Lease

Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance-Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|---|------|------|
| Kredite und Forderungen | 71 | -317 |
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | 0 | -22 |

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Im Vorjahr wurde die während der Laufzeit im kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von -11 Tsd. € infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die direkten Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | | 2015 | |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Positiver Marktwert | Negativer Marktwert | Positiver Marktwert | Negativer Marktwert |
| Devisentermingeschäfte | 0 | 289 | 0 | 34 |
| Zinsswaps | 0 | 0 | 0 | 410 |

Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euroraum und externen Kunden oder Lieferanten, die nicht im Euroraum ansässig sind. Dies betrifft vor allem Kunden oder Lieferanten in den Währungsräumen des US-Dollar und des japanischen Yen, die Produkte von SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen oder an diese verkaufen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Zum 31. Dezember 2016 bestehen drei offene Devisentermingeschäfte über den Terminverkauf von insgesamt 9,8 Mio. USD mit Valuta 2. Mai 2017 bzw. 31. Oktober 2017. Die Sicherungskurse belaufen sich auf 1,067 USD/EUR (5,0 Mio. USD), 1,1435 USD/EUR (1,8 Mio. USD) bzw. 1,1508 USD/EUR (3,0 Mio. USD).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnpromtigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 1.064 Tsd. € (Vorjahr: Reduzierung um 192 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungs-Exposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | | |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | USD | JPY | Summe |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5.572 | 2.110 | 7.682 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.519 | 2.278 | 4.797 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -401 | -374 | -775 |
| Netto-Exposure | 7.690 | 4.014 | 11.704 |
| Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro | -699 | -365 | -1.064 |

| <i>in Tsd. €</i> | 2015 | | |
|---|--------------|-----------|--------------|
| | USD | JPY | Summe |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.058 | 10 | 2.068 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 621 | 17 | 638 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -574 | -17 | -591 |
| Netto-Exposure | 2.105 | 10 | 2.115 |
| Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro | -191 | -1 | -192 |

(30) NAHESTEHENDE PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20% oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen“ – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

(31) FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

| <i>in Tsd. €</i> | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Bestellobligo | 24.996 | 19.540 |
| Miet- und Leasingverpflichtungen | 1.864 | 1.621 |
| Summe | 26.860 | 21.161 |

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

(32) ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

In der Konzernkapitalflussrechnung des SÜSS MicroTec-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten,

soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 619 Tsd. € (Vorjahr: -1.370 Tsd. €) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte. Für 2016 sind hier außerdem die Effekte aus der Zuführung zu einer Rückstellung für Abfindungen in Höhe von 750 Tsd. € enthalten.

(33) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung und Berichterstattung an den Vorstand und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Aufgrund der im Vergleich zu anderen Regionen rückläufigen Bedeutung wird über die Region Japan im Geschäftsjahr 2016 nicht mehr separat berichtet. Die in Japan erzielten Umsätze, die vor Ort getätigten Investitionen und das in Japan vorhandene Konzernvermögen werden unter der Region Asien und Pazifik zusammengefasst.

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden in die operativen Segmente Lithografie, Bonder und Fotomasken-Equipment aufgeteilt. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS MicroTec-Konzern die Produktlinien Mask-Aligner, Entwickler und Belacker sowie die Produktlinien UV-Projection und Laser-Processing. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Die Entwicklung und Produktion der Produktlinien UV-Projection und Laser-Processing erfolgen in Corona, USA. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für das Segment Lithografie tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der Gruppe dar und ist in den

Märkten Advanced Packaging, MEMS und Verbindungshalbleiter vertreten.

Im Segment Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. Der Vertrieb für das Segment Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig.

Das Segment Fotomasken-Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiter-Industrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Bereich Mikrooptik gezeigt.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. Infolge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec mit zwei Kunden Umsätze erzielt, die jeweils einen Anteil von mehr als 10% am gesamten Konzernumsatz darstellten. Auf einen Kunden entfielen dabei rund 22,6 Mio. €, mit dem anderen Kunden wurden Umsätze von rund 25,3 Mio. € erzielt. Die Umsätze mit diesen beiden Kunden entfallen mit rund 42,1 Mio. € auf das Segment Lithografie und mit rund 0,2 Mio. € auf das Segment Bonder. 5,6 Mio. € waren dem Segment Fotomasken-Equipment zuzurechnen. Im Vorjahr wurden mit einem Kunden Umsätze von rund 23,8 Mio. € erzielt, das waren rund 16% des Gesamtumsatzes.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben den Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch die Zuführung zu und die Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Verpflichtungen gezeigt. Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Für die geografische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. SÜSS MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 15.532 Tsd. € (Vorjahr: 18.552 Tsd. €) in Deutschland erzielt.

Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standorts der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt. Das langfristige Vermögen des Konzerns besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und Sachanlagen. Vom langfristigen Vermögen sind 32.216 Tsd. € (Vorjahr: 32.340 Tsd. €) Gesellschaften in Deutschland zuzurechnen; 7.709 Tsd. € (Vorjahr: 7.961 Tsd. €) entfallen auf ausländische Gesellschaften. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 1.934 Tsd. € (Vorjahr: 2.075 Tsd. €) in Deutschland vorgenommen.

(34) NACHTRAGSBERICHT

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

(35)

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT**VORSTAND DER KONZERNBEREITUNG****Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2016 waren:****Dr. Franz Richter** (seit 7. September 2016)

- Dr.-Ing., Eichenau,
Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche:

Marketing und Vertrieb, Konzernstrategie, Service, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Divisions/Produktlinien

Weitere Mandate:

- Siltronic AG, München (Mitglied des Aufsichtsrats)
- Meyer Burger Technology AG, Gwatt, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
- COMET Holding AG, Flamatt, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
- Scint-X AB, Stockholm, Schweden
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Michael Knopp

- Diplom-Kaufmann, Ratingen,
Finanzvorstand

Zuständigkeitsbereiche:

Finanz- und Rechnungswesen, IT, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Investor Relations

Weitere Mandate: keine**Walter Braun**

- Diplom-Ingenieur, Altensteig,
Produktionsvorstand

Zuständigkeitsbereiche:

Produktion, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Materialwirtschaft und Logistik

Weitere Mandate: keine**Dr. Per-Ove Hansson** (bis 16. August 2016)

- Dr. rer. nat. (Physik), Feldkirchen,
Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche:

Marketing und Vertrieb, Konzernstrategie, Service, Forschung und Entwicklung, Patentwesen, Divisions/Produktlinien

Weitere Mandate: keine**AUFSICHTSRAT****Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2016 waren:****Dr. Stefan Reineck**

- Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:

- AttoCube Systems AG, München
(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- bis 2. Juni 2016: AWS-Group AG, Heilbronn
(Mitglied im Aufsichtsrat)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA
(Mitglied im Board of Directors)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- bis 25. Oktober 2016: Acceed 4.0 Beteiligungs-GmbH (vormals: Accel 4.0 Beteiligungs-GmbH), Heilbronn
(Beiratsvorsitzender)

Jan Teichert

- Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau, Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate: keine**Gerhard Pegam**

- Au/Bad Feilnbach, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting, Au/Bad Feilnbach; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)

VERGÜTUNG VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von 2.153 Tsd. € (Vorjahr: 1.568 Tsd. €). Der Betrag der Vorstandsvergütung enthält eine Abfindung in Höhe von 750 Tsd. € für den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Dr. Per-Ove Hansson, der am 26. August 2016 ausgeschieden ist.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen 203 Tsd. € (Vorjahr: 188 Tsd. €).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

| | 2016 | | 2015 | |
|---------------------|--------|----------|--------|----------|
| | Aktien | Optionen | Aktien | Optionen |
| Dr. Franz Richter | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Knopp | 19.900 | 0 | 18.350 | 0 |
| Walter Braun | 18.300 | 0 | 3.150 | 0 |
| Dr. Per-Ove Hansson | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Stefan Reineck | 9.600 | 0 | 9.600 | 0 |

(36) MITARBEITER

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 713 Mitarbeiter (Vorjahr: 686 Mitarbeiter) in der SÜSS MicroTec-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

| | 2016 | 2015 |
|------------------------|------------|------------|
| Verwaltung | 68 | 61 |
| Marketing und Vertrieb | 262 | 262 |
| Produktion und Technik | 381 | 375 |
| Summe | 711 | 698 |

(37) HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Im aktuellen Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Honoraraufwendungen nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von 251 Tsd. € (Vorjahr: 227 Tsd. €) erfasst. Auf Netzwerkpartner des Konzernabschlussprüfers (weitere Mitglieder von BDO International) entfielen im Geschäftsjahr Honoraraufwendungen von 9 Tsd. € (Vorjahr: 40 Tsd. €). Sämtliche Aufwendungen betreffen ausschließlich die Abschlussprüfung.

Die Aufwendungen für die Abschlussprüfung enthalten das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch BDO geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Vom Honorar für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses entfallen rund 30 Tsd. € (Vorjahr: 30 Tsd. €) auf die Prüfung des Einzelabschlusses der SÜSS MicroTec AG.

Beratungsleistungen wurden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder durch andere Mitglieder von BDO International weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr erbracht.

(38) CORPORATE GOVERNANCE

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2016 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprechen werden und den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2015 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Im Januar 2017 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer im Aufsichtsrat – entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 5. Mai 2015 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2016 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter > www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

(39)**FREIGABE DES ABSCHLUSSES**

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss am 9. März 2017 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 9. März 2017

Der Vorstand



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der Süss MicroTec AG zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, den 9. März 2017

SÜSS MicroTec Aktiengesellschaft
Der Vorstand



Dr. Franz Richter
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand



Walter Braun
Produktionsvorstand

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG, Garching, den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 9. März 2017

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

S. Wiedemann
Wirtschaftsprüfer

T. Steiner
Wirtschaftsprüfer

Glossar

3D-Integration

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: in 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer-Level-Packaging-Ebene gestapelt werden, ohne durch sogenannte Through-Silicon-Vias (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-a-Chip) sowie weitere Verfahren subsumiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire-Bonding (Drahtbonden) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch Through-Silicon-Vias (TSV) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

300-mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben z. B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (etwa 42%) der heute weltweit verwendeten Siliziumscheiben hat einen Durchmesser von 300 mm. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die aus einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die aus einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzelnen Chip.

Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter Advanced Packaging versteht man weiterentwickelte Packaging-Verfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten Frontend der Chipfertigung, eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

Backend

Backend bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochip-Fertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

Belacker (Beschichtungsgerät)

Belacker sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

Bonden

Mit dem Begriff „Bonden“ bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhäsives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion-Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

Bonder (Verbindungsgerät)

Ein Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker etc. funktionieren.

Bump

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold o. Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugeln auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstellen, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire-Bonding oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Belacker, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

Compound-Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

Cost-of-Ownership

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die Cost-of-Ownership der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende Cost-of-Ownership ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

Die

„Die“, IC (Integrated Circuit) und Chip sind oft synonym verwendete Begriffe. „Dies“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der „Dies“ spricht man von Chips.

DRAM

DRAM steht für „Dynamic Random Access Memory“. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird.

Fab

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen, modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis 4 Mrd. USD.

Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h., der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

Fotoresist

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

Foundry

Foundry ist eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre Forschung und Entwicklung für Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

Frontend

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

Halbleiter

Ein kristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC (Integrated Circuit)

Ein Integrated Circuit ist ein integrierter Schaltkreis und besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum in einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele 10 Millionen solcher Zellen in einen Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

IDM (Integrated-Device-Manufacturer)

Hierbei handelt es sich um Unternehmen in der Halbleiterbranche, die Halbleiterbauteile selbst entwickeln, produzieren und vermarkten.

Laser-Prozessierung

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie z. B. die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten in Piko-sekunden, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. SÜSS MicroTec bietet zwei Laser-Technologien an:

Excimer-Laserabdampfung: In der Mikrostrukturierung bietet der Einsatz von Excimer-Laser vor allem Möglichkeiten für eine Materialabdampfung. Durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung lässt sich Material von einer Oberfläche abtragen. Dabei stößt eine fotochemische Reaktion eine Elektronenanregung an, die in einem plötzlichen Druckanstieg und einer explosiven Abtragung von Material in Form von Monomeren und Gasen resultiert. Die thermische Wirkung ist hierbei minimal – die Prozesstechnologie schont temperaturempfindliche Materialien. Die Systeme verwenden eine Fotomaske, die mit einem Laserstrahl beleuchtet wird. Eine Projektionsoptik zwischen Maske und Wafer bildet, ähnlich einem Projektionsstepper in der Lithografie, die Maskenstrukturen auf dem Wafer ab. Jedoch wird das Material nicht belichtet, sondern direkt abgetragen. Mit einem Step-and-repeat-Verfahren wird der komplette Wafer strukturiert.

Prozessierung mit Festkörper-Laser: Die Festkörper-Laser-Technologie verspricht alle Vorteile der Laser-Prozessierung: Sie erreicht hohe Auflösungen von bis zu zwei Mikrometern und sorgt für besonders präzise Ergebnisse. Strukturierungsprozesse laufen ohne thermische Nebenwirkungen ab. Die Systeme kommen ohne Maske aus und verwenden eine direkte Schreibmethode.

LED (Light Emitting Diode)

Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmals so große Lebensdauer wie eine normale Glühlampe.

Lithografie

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichten-aufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresists, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32 nm (0,032 µm) bis 0,6 µm. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines IC benötigt werden; die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

Mask-Aligner (Belichtungsgerät)

Mask-Aligner richten eine Glasmasken submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

MEMS (Micro Electro Mechanical System)

MEMS steht für „Micro Electro Mechanical System“ und ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

Mikrometer/Mikron

Metrisches Längenmaß; Zeichen: µm. Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 µm.

Mikrosystem

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

Mikrosystemtechnik

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet „Micro System Technology“ oder der häufiger verwendete Begriff „Micro Electro Mechanical System“ (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Auslösen des Airbags eingesetzt wird, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

Nanoimprinting/Nano-Imprint-Lithografie (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

Nanotechnologie

Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

Optoelektronik

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiter-Laser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile, wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer, zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

OSAT (Outsourced Assembly- and Test-Houses)

Diese Unternehmen sind im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie angesiedelt. Sie offerieren Packaging-Lösungen, Testsysteme und weitere Serviceleistungen für Halbleiterhersteller, ohne dabei an einen bestimmten Hersteller gebunden zu sein. Schwerpunkt ist häufig das Packaging und Assembly von ICs und anderen Halbleiterprodukten.

Packaging-Foundries

Siehe Backend.

Projektionslithografie

Während bei der Vollfeldlithografie (Mask-Alignern) der komplette Wafer in einem Vorgang belichtet wird, werden bei projektlithografischen Prozessen typischerweise nur einzelne Bereiche des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die komplette Belichtung des Wafers wird dann entweder schrittweise (Step and repeat) oder kontinuierlich (Scan) durchgeführt. SÜSS MicroTec fertigt 1:1-Projektionsscanner für das Halbleiter-Mid- und -Backend. Hierbei wird eine Vollfeldmaske verwendet und der Wafer in einem Scannvorgang belichtet. Eine Verkleinerung der Strukturgrößen von der Maske zum Wafer findet nicht statt. Die Projektionsscanner-Technologie von SÜSS MicroTec kombiniert Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie und bietet eine Alternative zu Mask-Alignern und Projektionssteppern.

Sensor

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung; diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

Silizium

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften; halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

System-on-a-Chip

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten; bis vor kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturweiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich ist und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-a-Chip immer größere Bedeutung.

Through-Silicon-Via (TSV)

Bei der Through-Silicon-Via-Technik werden die einzelnen Chipkomponenten übereinandergestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen (Through-Silicon-Vias) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten, so lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

Tool

Maschine, Werkzeug, Roboter usw.; Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zu einer Produktionslinie kombiniert werden.

Verbindungshalbleiter

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.); Vorteile gegenüber einfachen Elementhalbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell, können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

Wafer

Runde Scheiben z. B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc.), aus denen Chips produziert werden; in den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300-mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200-mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30% niedriger.

Wire-Bonding

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

Yield

Die Ausbeute ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

Impressum

Herausgeber ————— SÜSS MicroTec AG
Redaktion ————— Finance: Julia Natterer
Investor Relations: Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer ————— BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung ————— wagneralliance Kommunikation GmbH, Offenbach
Übersetzung ————— EnglishBusiness AG, Hamburg
Druck ————— Eberl Print GmbH, Immenstadt
Fotos ————— SÜSS MicroTec AG, Garching
Christian Siebold, München
Marek Vogel, München
Creativ Fotostudio Allan Richard Tobis, München
Fraunhofer IZM, Berlin
wang song/Shutterstock.com
Pressmaster/Shutterstock.com

Kontakt

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 89 32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Telefon: +49 89 32007-161
E-Mail: ir@suss.com
www.suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

Fünfjahresübersicht

| <i>in Mio. €</i> | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|
| Geschäftsentwicklung | | | | | |
| Auftragseingang | 161,1 | 188,6 | 134,3 | 135,0 | 157,2 |
| Auftragsbestand zum 31.12. | 101,5 | 117,6 | 75,6 | 85,7 | 86,5 |
| Umsatz gesamt | 177,6 | 148,5 | 145,3 | 134,5 | 163,8 |
| Umsatzrendite | 2,8% | 0,1% | 3,2% | -11,9% | 4,6% |
| Rohertrag | 58,6 | 49,4 | 48,8 | 21,8 | 57,4 |
| Rohertragsmarge | 33,0% | 33,3% | 33,6% | 16,2% | 35,0% |
| Herstellungskosten | 119,0 | 99,2 | 96,5 | 112,7 | 106,4 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 14,1 | 12,8 | 10,5 | 10,2 | 9,7 |
| EBITDA | 15,3 | 9,2 | 12,6 | -13,4 | 18,6 |
| EBITDA-Marge | 8,6% | 6,2% | 8,7% | -10,0% | 11,4% |
| EBIT | 11,1 | 5,0 | 8,4 | -19,4 | 11,7 |
| EBIT-Marge | 6,3% | 3,4% | 5,8% | -14,4% | 7,1% |
| Ergebnis nach Steuern | 5,0 | 0,2 | 4,6 | -16,0 | 7,6 |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) | 0,26 | 0,01 | 0,24 | -0,84 | 0,40 |
| Bilanz und Cashflow | | | | | |
| Eigenkapital | 124,4 | 118,7 | 116,1 | 109,4 | 127,2 |
| Eigenkapitalquote | 69,2% | 67,0% | 69,1% | 60,8% | 70,5% |
| Eigenkapitalrentabilität | 4,0% | 0,2% | 4,0% | -14,6% | 6,0% |
| Bilanzsumme | 179,6 | 177,2 | 168,0 | 179,9 | 180,4 |
| Net Cash | 31,1 | 40,0 | 38,0 | 35,7 | 32,3 |
| Free Cashflow ¹ | -9,1 | 1,3 | 2,1 | 4,1 | -4,5 |
| Weitere Kennzahlen | | | | | |
| Investitionen | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 12,2 | 4,2 |
| Investitionsquote | 2,0% | 2,3% | 2,1% | 9,1% | 2,6% |
| Abschreibungen | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | 6,8 |
| Mitarbeiter zum 31.12. | 711 | 698 | 659 | 655 | 704 |

¹ Vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen.

Finanzkalender 2017

- 30. März** ——— Geschäftsbericht 2016
- 4. Mai** ——— Quartalsbericht 2017
- 31. Mai** ——— Hauptversammlung 2017, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München
- 10. August** ——— Halbjahresbericht 2017
- 9. November** — Neunmonatsbericht 2017

SÜSS MicroTec AG

Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 89 32007-0
E-Mail: info@suss.com

www.suss.com